05.11.2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 9月24日

REC'D 0 4 JAN 2005

WIPO

POT

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-332416

[ST. 10/C]:

[JP2003-332416]

出 願 人
Applicant(s):

三星ダイヤモンド工業株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

# PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月16日

161

17



DEST AVAILABLE COPY



【書類名】 特許願 【整理番号】 P03-18

【提出日】 平成15年 9月24日 【あて先】 特許庁長官 殿 【国際特許分類】 CO3B 33/02

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府吹田市南金田2丁目12番12号 三星ダイヤモンド工業

株式会社内

【氏名】 西尾 仁孝

【発明者】

大阪府吹田市南金田2丁目12番12号 三星ダイヤモンド工業 【住所又は居所】

株式会社内

【氏名】 岡島 康智

【発明者】

大阪府吹田市南金田2丁目12番12号 三星ダイヤモンド工業 【住所又は居所】

株式会社内

【氏名】 大島 幸雄

【発明者】

大阪府吹田市南金田2丁目12番12号 三星ダイヤモンド工業 【住所又は居所】

株式会社内

【氏名】 大成 弘行

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府吹田市南金田2丁目12番12号 三星ダイヤモンド工業

株式会社内

【氏名】 吉本 和宏

【特許出願人】

【識別番号】 390000608

【氏名又は名称】 三星ダイヤモンド工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100078282

【弁理士】

【氏名又は名称】 山本 秀策

【選任した代理人】

【識別番号】 100062409

【弁理士】

【氏名又は名称】 安村 高明

【選任した代理人】

【識別番号】 100113413

【弁理士】

【氏名又は名称】 森下 夏樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001878 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 0209950 【包括委任状番号】



# 【書類名】特許請求の範囲

### 【請求項1】

中空直方体状の架台と、

該架台内に搬入された基板の側縁部の少なくとも1箇所をクランプするように、該架台 に取り付けられたクランプ装置と、

該クランプ装置にてクランプされた該基板の上面側および下面側から該基板を分断させる一対の基板分断装置と、

前記中空直方体状の架台の一辺に沿って往復移動可能であって、前記一対の基板分断装置がその移動方向とは直交する方向に沿って移動可能に取り付けられたスクライブ装置ガイド体と、

を具備することを特徴とする基板分断システム。

## 【請求項2】

前記クランプ装置によってクランプされた前記基板を支持する基板支持装置を備えることを特徴とする請求項1に記載の基板分断システム。

### 【請求項3】

前記基板支持装置は、前記スクライブ装置ガイド体の移動方向の一方の側方に設けられた第1基板支持部を具備することを特徴とする請求項2に記載の基板分断システム。

### 【請求項4】

前記第1基板支持部は、前記スクライブ装置ガイド体の移動方向に沿ってそれぞれ平行移動する複数の第1基板支持ユニットを備え、各第1基板支持ユニットは、該スクライブ装置ガイド体の一方への移動に伴ってスクライブ装置ガイド体と共に移動することを特徴とする請求項3に記載の基板分断システム。

### 【請求項5】

前記第1基板支持ユニットは基板を支持する複数のベルトを具備することを特徴とする 請求項4に記載の基板分断システム。

#### 【請求項6】

前記複数のベルトを前記スクライブ装置ガイド体の移動に伴い選択的に周回移動させる 少なくとも1つのクラッチユニットを備えることを特徴とする請求項5に記載の基板分断 システム。

#### 【請求項7】

前記基板支持装置には前記スクライブ装置ガイド体の移動方向の他方の側方に設けられた第2基板支持部をさらに具備することを特徴とする請求項2に記載の基板分断システム

#### 【請求項8】

前記第2基板支持部は、前記スクライブ装置ガイド体の移動方向に沿ってそれぞれ平行移動する複数の第2基板支持ユニットを備え、各第1基板支持ユニットは、該スクライブ装置ガイド体の一方への移動に伴ってスクライブ装置ガイド体と共に移動することを特徴とする請求項7に記載の基板分断システム。

### 【請求項9】

前記第2基板支持ユニットは基板を支持する複数のベルトを具備することを特徴とする 請求項8に記載の基板分断システム。

#### 【請求項10】

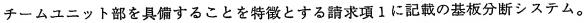
前記複数のベルトを前記スクライブ装置ガイド体の移動に伴い選択的に周回移動させる 少なくとも1つのクラッチユニットを備えることを特徴とする請求項9に記載の基板分断 システム。

### 【請求項11】

前記基板分断装置はカッターホイールにサーボモータを用いて前記基板への押圧力を伝達するカッターヘッドを具備することを特徴とする請求項1に記載の基板分断システム。

### 【請求項12】

前記基板分断装置にてスクライブラインが刻まれた基板の表裏面へ蒸気を吹きかけるス



## 【請求項13】

前記スチームユニット部には基板の表裏面を乾燥させる基板乾燥手段が設けられていることを特徴とする請求項12に記載の基板分断システム。

## 【請求項14】

前記スチームユニット部で分断された基板を取り出す基板搬出装置を具備することを特徴とする請求項10に記載の基板分断システム。

## 【請求項15】

前記基板搬送装置は、基板を保持する基板保持手段と、該基板が保持された該基板保持 手段を、該基板に対して垂直な第1の軸の回りに回転させる基板回転手段と、該基板回転 手段を、該基板保持手段にて保持された基板に対して垂直な前記第1の軸とは異なる第2 の軸の回りに旋回させる手段とを備える搬出ロボットを具備することを特徴とする請求項 14に記載の基板分断システム。

## 【請求項16】

前記基板搬送装置により搬送される基板の表裏を反転する基板反転手段を具備すること を特徴とする請求項14に記載の基板分断システム。

## 【請求項17】

前記基板を位置決めする位置決めユニット部を具備することを特徴とする請求項1に記載の基板分断システム。

## 【請求項18】

前記スクライブ装置ガイド体でスクライブされた基板をスチームユニット部へ搬送する 搬送ユニットを備えることを特徴とする請求項1に記載の基板分断システム。

## 【請求項19】

分断された基板の不要部を除去する除去手段を具備することを特徴とする請求項1に記載の基板分断システム。

## 【請求項20】

前記複数のベルトは基板搬入側のフレームと基板搬出側のフレーム間に張られ、前記第 1基板支持部が移動中、該複数のベルトがスクライブ装置ガイド体の下方へ沈み込む、ま たはスクライブ装置ガイド体の下方から上方へ現れてくることを特徴とする請求項5に記 載の基板分断システム。

### 【請求項21】

前記複数のベルトは基板搬入側のフレームと基板搬出側のフレーム間に張られ、前記第2基板支持部が移動中、該複数のベルトがスクライブ装置ガイド体の下方へ沈み込む、またはスクライブ装置ガイド体の下方から上方へ現れてくることを特徴とする請求項9に記載の基板分断システム。

## 【請求項22】

前記基板は、一対のマザー基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板であることを特徴とする請求項1に記載の基板分断システム。

## 【請求項23】

請求項1に記載の基板分断システムに、分断された基板の端面部を面取りする面取りシステムが接続されていることを特徴とする基板製造装置。

### 【請求項24】

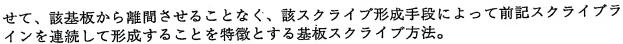
請求項1に記載の基板分断システムに分断された基板の機能を検査する検査システムが 接続されていることを特徴とする基板製造装置。

#### 【請求項25】

分断された基板の機能を検査する検査システムが接続されていることを特徴とする請求 項19に記載の基板製造装置。

## 【請求項26】

基板の上面および下面にスクライプラインを形成するスクライブ方法において、 該基板の厚さ方向に沿った垂直クラックを形成するスクライブライン形成手段を対向さ



# 【請求項27】

前記スクライブライン形成手段によって前記直線状のスクライブラインが3本以上形成されて、形成された全てのスクライブラインによって閉曲線が形成されることを特徴とする請求項26に記載の基板スクライブ方法。

# 【請求項28】

前記スクライブライン形成手段によって、長方形の閉曲線が形成されることを特徴とする請求項27に記載の基板スクライブ方法。

## 【請求項29】

前記スクライブライン形成手段は、ディスク状であってその外周に前記基板の表面を転接する刃先が形成されたカッターホイールチップであることを特徴とする請求項26に記載の基板スクライブ方法。

# 【請求項30】

前記カッターホイールチップは、刃先に所定のピッチで複数の突起が形成されていることを特徴とする請求項29に記載の基板スクライブ方法。

## 【請求項31】

前記カッターホイールチップによって前記少なくとも2本のスクライブラインを形成した後に、形成された少なくとも2本のスクライプラインに沿ったサブスクライプラインを該カッターホイールチップによって形成することを特徴とする請求項30に記載の基板スクライブ方法。

## 【請求項32】

前記サブスクライブラインが、前記カッターホイールチップを前記基板の表面から離間 させることなく、前記基板に形成された前記少なくとも2本のスクライブラインに連続し て形成することを特徴とする請求項31に記載の基板スクライブ方法。

# 【請求項33】

前記カッターホイールチップは、一方のスクライブラインを形成した後に、円形状の軌跡を描くように前記基板を移動した後に、他方のスクライブラインを形成することを特徴とする請求項26に記載の基板スクライブ方法。

### 【請求項34】

前記カッターホイールチップは、円形状の軌跡を描くように前記基板上を移動する際に、前記基板に対する圧力が、前記各スクライプラインをそれぞれ形成する場合における前記基板に対する圧力よりも低減されていることを特徴とする請求項26に記載の基板スクライプ方法。

## 【請求項35】

基板の上面および下面にスクライブラインを形成するスクライブ方法において、

該基板の厚さ方向に沿った垂直クラックを形成するスクライブライン形成手段を対向させて、該基板の分断予定ラインに沿って主スクライブラインを形成する工程と、

形成された主スクライブラインから所定の間隔をあけて該主スクライブラインに沿って、補助スクライブラインを形成する工程と、

を具備することを特徴とする基板分断方法。

# 【請求項36】

前記補助スクライブラインは、前記主スクライブラインとは 0.5 mm~1.0 mmの間隔をあけて形成されていることを特徴とする請求項 35 に記載の基板分断方法。

## 【請求項37】

前記主スクライブラインは、基板表面から基板の厚さ方向の80%以上に達した垂直クラックによって形成されていることを特徴とする請求項35または請求項36に記載の基板分断方法。

## 【請求項38】

前記主スクライブラインは、基板表面から基板の厚さ方向の90%以上に達した垂直ク



ラックによって形成されていることを特徴とする請求項35に記載の基板分断方法。

## 【請求項39】

前記主スクライブラインは、基板表面を転動する円板状のカッターホイールによって形成されており、該カッターホイールは、その外周面における厚さ方向の中央部が鈍角のV字形状になるように外方に突出しており、その鈍角になった部分に、所定の高さの複数の突起が、所定のピッチで全周にわたって設けられていることを特徴とする請求項35に記載の基板分断方法。

# 【請求項40】

前記カッターホイールによる主スクライブラインの形成方向と補助スクライブラインの 形成方向とが反対になっており、該カッターホイールが、主スクライブラインおよび補助 スクライブラインを基板表面と接触した状態で連続して形成することを特徴とする請求項 39に記載の基板分断方法。

## 【請求項41】

前記主スクライプラインまたは補助スクライプラインが、前記分断予定ラインの少なく とも一方の端部から適当な間隔をあけて形成されることを特徴とする請求項35に記載の 基板分断方法。

## 【請求項42】

基板の上面および下面のそれぞれにスクライブラインが形成された基板を分断する方法 において、

該基板の上面および下面を加熱して、該基板を分断することを特徴とする基板分断方法



# 【書類名】明細書

【発明の名称】基板分断システム、基板製造装置、基板スクライブ方法および基板分断方法

## 【技術分野】

# [0001]

本発明は、液晶表示装置等の表示パネルに使用されるガラス基板等のマザー基板を含む、種々の材料のマザー基板を分断するために使用される基板分断システムおよび基板分断ラインシステムに関し、特に、一対の脆性材料基板を相互に貼り合わせた貼り合わせマザー基板の分断に好適に使用することができる基板分断システム、基板製造装置、基板スクライブ方法、基板分断方法に関する。

## 【背景技術】

# [0002]

液晶表示装置等の表示パネルは、通常、脆性材料基板であるガラス基板を用いて形成されている。液晶表示装置は、一対のガラス基板を、適当な間隔を形成して貼り合わせて、 その間隙内に液晶を封入することによって表示パネルとされる。

### [0003]

このような表示パネルを製造する際には、マザーガラス基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板を分断することによって、貼り合わせマザー基板から複数の表示パネルを取り出す加工が行われている。貼り合わせマザー基板を分断するために使用されるスクライブ装置が、実公昭59-22101号公報(特許文献1)に開示されている。

## [0004]

図56は、このスクライブ装置の概略構成図である。このスクライブ装置950は、貼り合わせマザー基板908の両側の側縁部をそれぞれ載置するテーブル951を備えている。テーブル951には、貼り合わせマザー基板908の各側縁部をクランプするクランプ具952が取り付けられている。スクライブ装置950は、貼り合わせマザー基板908の上下にそれぞれ設けられた一対のカッターヘッド953および954を備えている。各カッターヘッド953および954は、貼り合わせマザー基板908を挟んで相互に対向した状態になっている。

### [0005]

このような構成のスクライブ装置950においては、貼り合わせマザー基板908が各クランプ具952によって各テーブル951にそれぞれ固定されると、一対のカッターへッド953および954によって、貼り合わせマザー基板908の表面および裏面が、それぞれ同時にスクライブされて、スクライブラインが形成される。

【特許文献1】 実公昭59-22101号公報

## 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

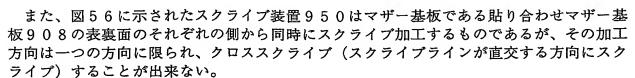
### [0006]

しかしながら、このようなスクライブ装置 9 5 0 では、スクライブラインが形成された 貼り合わせマザー基板 9 0 8 を分断するためのブレイク装置が別途必要である。また、ブ レイク装置によって貼り合わせマザー基板 9 0 8 を分断する際には、貼り合わせマザー基 板 9 0 8 の一方のマザー基板を分断した後に、他方のマザー基板を分断するために、貼り 合わせマザー基板 9 0 8 を反転させる(上面が下面になるように裏返す)必要があり、貼 り合わせマザー基板 9 0 8 から表示パネルを分断させるためには、複雑なラインシステム を構築させなければならない。

### [0007]

このようなスクライブ装置950を用いて貼り合わせマザー基板908から表示パネルを分断させるためには、スクライブ装置950の数倍の設置面積を有する複雑なラインシステムを構築させなければならず、表示パネルの製造コストを押し上げる一つの原因となっていた。

## [0008]



## [0009]

このため、クロススクライブするためにはさらに別のスクライブ装置が必要であり、貼り合わせマザー基板908のスクライブ加工効率が非常に悪いという問題がある。

## [0010]

また、上述のスクライブ装置 9 5 0 と同様の装置を用いて各種マザー基板をその表裏面のそれぞれ側から同時に分断加工する場合においても一回の基板のセッティングで直交する 2 つの方向の加工ができないという問題がある。

### [0011]

本発明は、このような問題を解決するものであり、その目的は設置面積を小さくしてコンパクトであり、また、各種マザー基板を効率よく分断することができる基板分断システムおよび基板分断システムを提供することにある。

### 【課題を解決するための手段】

## [0012]

本発明の基板分断システムは、中空直方体状の架台と、該架台内に搬入された基板の側縁部の少なくとも1箇所をクランプするように、該架台に取り付けられたクランプ装置と、該クランプ装置にてクランプされた該基板の上面側および下面側から該基板を分断させる一対の基板分断装置と、前記中空直方体状の架台の一辺に沿って往復移動可能であって、前記一対の基板分断装置がその移動方向とは直交する方向に沿って移動可能に取り付けられたスクライブ装置ガイド体と、を具備することを特徴とする。

## [0013]

また、前記クランプ装置によってクランプされた前記基板を支持する基板支持装置を備えることを特徴とする。

## [0014]

さらに、前記基板支持装置は、前記スクライブ装置ガイド体の移動方向の一方の側方に 設けられた第1基板支持部を具備することを特徴とする。

また、前記第1基板支持部は、前記スクライブ装置ガイド体の移動方向に沿ってそれぞれ平行移動する複数の第1基板支持ユニットを備え、各第1基板支持ユニットは、該スクライブ装置ガイド体の一方への移動に伴ってスクライブ装置ガイド体と共に移動することを特徴とする。

#### [0015]

さらに、前記第1基板支持ユニットは基板を支持する複数のベルトを具備することを特 徴とする。

### [0016]

また、 前記複数のベルトを前記スクライブ装置ガイド体の移動に伴い選択的に周回移動させる少なくとも1つのクラッチユニットを備えることを特徴とする。

#### [0017]

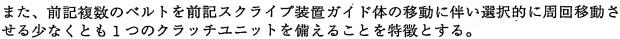
さらに、前記基板支持装置には前記スクライブ装置ガイド体の移動方向の他方の側方に 設けられた第2基板支持部をさらに具備することを特徴とする。

## [0018]

また、前記第2基板支持部は、前記スクライブ装置ガイド体の移動方向に沿ってそれぞれ平行移動する複数の第2基板支持ユニットを備え、各第1基板支持ユニットは、該スクライブ装置ガイド体の一方への移動に伴ってスクライブ装置ガイド体と共に移動することを特徴とする。

#### [0019]

さらに、前記第2基板支持ユニットは基板を支持する複数のベルトを具備することを特 徴とする。



# [0020]

さらに、前記基板分断装置はカッターホイールにサーボモータ用いて前記基板への押圧 力を伝達するカッターヘッドを具備することを特徴とする。

### [0021]

また、前記基板分断装置にてスクライブラインが刻まれた基板の表裏面へ蒸気を吹きかけるスチームユニット部を具備することを特徴とする。

## [0022]

さらに、前記スチームユニット部には基板の表裏面を乾燥させる基板乾燥手段が設けられていることを特徴とする。

### [0023]

また、前記スチームユニット部で分断された基板を取り出す基板搬出装置を具備することを特徴とする。

## [0024]

さらに、前記基板搬送装置は、基板を保持する基板保持手段と、該基板が保持された該 基板保持手段を、該基板に対して垂直な第1の軸の回りに回転させる基板回転手段と、該 基板回転手段を、該基板保持手段にて保持された基板に対して垂直な前記第1の軸とは異 なる第2の軸の回りに旋回させる手段とを備える搬出ロボットを具備することを特徴とす る。

### [0025]

また、前記基板搬送装置により搬送される基板の表裏を反転する基板反転手段を具備することを特徴とする。

### [0026]

さらに、前記基板を位置決めする位置決めユニット部を具備することを特徴とする。

## [0027]

また、前記スクライブ装置ガイド体でスクライブされた基板をスチームユニット部へ搬送する搬送ユニットを具備することを特徴とする。

さらに、分断された基板の不要部を除去する除去手段を具備することを特徴とする。

## [0028]

また、前記複数のベルトは基板搬入側のフレームと基板搬出側のフレーム間に張られ、 前記第1基板支持部が移動中、該複数のベルトがスクライブ装置ガイド体の下方へ沈み込 む、またはスクライブ装置ガイド体の下方から上方へ現れてくることを特徴とする。

## [0029]

さらに、前記複数のベルトは基板搬入側のフレームと基板搬出側のフレーム間に張られ、前記第2基板支持部が移動中、該複数のベルトがスクライブ装置ガイド体の下方へ沈み込む、またはスクライブ装置ガイド体の下方から上方へ現れてくることを特徴とする。

## [0030]

前記基板は、一対のマザー基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板であることを特徴とする。

#### [0031]

本発明の基板製造装置は上記の基板分断システムに、分断された基板の端面部を面取りする面取りシステムが接続されていることを特徴とする。

さらに、分断された基板の機能を検査する検査システムが接続されていることを特徴とする。

本発明の基板スクライブ方法は基板の上面および下面にスクライブラインを形成するスクライブ方法において、該基板の厚さ方向に沿った垂直クラックを形成するスクライブライン形成手段を対向させて、該基板から離間させることなく、該スクライブ形成手段によって前記スクライブラインを連続して形成することを特徴とする。

また、前記スクライブライン形成手段によって前記直線状のスクライブラインが3本以上

形成されて、形成された全てのスクライブラインによって閉曲線が形成されることを特徴とする。

# [0032]

さらに、前記スクライブライン形成手段によって、長方形の閉曲線が形成されることを 特徴とする。

## [0033]

また、前記スクライブライン形成手段は、ディスク状であってその外周に前記基板の表面を転接する刃先が形成されたカッターホイールチップであることを特徴とする。

### [0034]

さらに、前記カッターホイールチップは、刃先に所定のピッチで複数の突起が形成されていることを特徴とする。

### [0035]

また、前記カッターホイールチップによって前記少なくとも2本のスクライブラインを 形成した後に、形成された少なくとも2本のスクライブラインに沿ったサブスクライブラ インを該カッターホイールチップによって形成することを特徴とする。

### [0036]

さらに、前記サブスクライブラインが、前記カッターホイールチップを前記基板の表面から離間させることなく、前記基板に形成された前記少なくとも2本のスクライブラインに連続して形成することを特徴とする。

## [0037]

また、前記カッターホイールチップは、一方のスクライブラインを形成した後に、円形 状の軌跡を描くように前記基板を移動した後に、他方のスクライブラインを形成すること を特徴とする。

## [0038]

さらに、前記カッターホイールチップは、円形状の軌跡を描くように前記基板上を移動する際に、前記基板に対する圧力が、前記各スクライブラインをそれぞれ形成する場合における前記基板に対する圧力よりも低減されていることを特徴とする。

本発明の基板分断方法は、基板の上面および下面にスクライブラインを形成するスクライブ方法において、該基板の厚さ方向に沿った垂直クラックを形成するスクライブライン形成手段を対向させて、該基板の分断予定ラインに沿って主スクライブラインを形成する工程と、形成された主スクライブラインから所定の間隔をあけて該主スクライブラインに沿って、補助スクライブラインを形成する工程と、を具備することを特徴とする。

### [0039]

また、前記補助スクライプラインは、前記主スクライプラインとは $0.5mm\sim1.0$ mmの間隔をあけて形成されていることを特徴とする。

さらに、前記主スクライブラインは、基板表面から基板の厚さ方向の80%以上に達した 垂直クラックによって形成されていることを特徴とする。

また、前記主スクライブラインは、基板表面から基板の厚さ方向の90%以上に達した垂直クラックによって形成されていることを特徴とする。

さらに、前記主スクライブラインは、基板表面を転動する円板状のカッターホイールによって形成されており、該カッターホイールは、その外周面における厚さ方向の中央部が鈍角のV字形状になるように外方に突出しており、その鈍角になった部分に、所定の高さの複数の突起が、所定のピッチで全周にわたって設けられていることを特徴とする。

また、前記カッターホイールによる主スクライブラインの形成方向と補助スクライブラインの形成方向とが反対になっており、該カッターホイールが、主スクライブラインおよび補助スクライブラインを基板表面と接触した状態で連続して形成することを特徴とする。さらに、前記主スクライブラインまたは補助スクライブラインが、前記分断予定ラインの少なくとも一方の端部から適当な間隔をあけて形成されることを特徴とする。

また、基板の上面および下面のそれぞれにスクライブラインが形成された基板を分断する 方法において、該基板の上面および下面を加熱して、該基板を分断することを特徴とする

# 【発明の効果】

[0040]

本発明の基板分断システムは、このように、基板をクランプ装置で保持し、分断ガイド体の移動に応じてスライドする基板支持装置で支持する構成としたことで、一回の基板のセッティングで基板の表裏面側から同時に直交する2つの方向の分断加工が可能となったため、本システム全体がコンパクトなものとなり、また、各種基板を効率よく分断することが出来る。

# 【発明を実施するための最良の形態】

[0041]

以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて詳細に説明する。

[0042]

〈実施の形態1〉

図1および図2は、本発明の基板分断システムの実施形態の一例をそれぞれ異なる方向から見た全体を示す概略斜視図である。

[0043]

なお、本発明において、「基板」には、複数の基板に分断されるマザー基板、また、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板およびセラミックス基板、半導体基板、ガラス 基板等の脆性材料基板等の単板が含まれる。さらに、このような単板に限らず、一対の基 板同士を貼り合わせた貼り合わせ基板、一対の基板同士を積層させた積層基板も含まれる

### [0044]

本発明の基板分断システムは、例えば、一対のガラス基板が、相互に貼り合わせられた液晶表示装置のパネル基板(表示パネル用貼り合わせ基板)を製造する際、この基板分断システムによって、一対のマザーガラス基板が相互に貼り合わされた貼り合わせマザー基板90を複数枚のパネル基板(表示パネル用貼り合わせ基板)に分断する。

### [0045]

本実施の形態1の基板分断システム1において、第1基板支持部20Aが配置される側を基板搬入側、基板搬出装置80が配置されている側を基板搬出側として以下の説明を行う。また、本発明の基板分断システム1において、基板が搬送されていく方向(基板の流れ方向)は基板搬入側から基板搬出側に向かう+Y方向である。また、この基板が搬送されていく方向はスクライブ装置ガイド体30に対して水平状態で直交する方向であり、スクライブ装置ガイド体30はX方向に沿って設けられる。

### [0046]

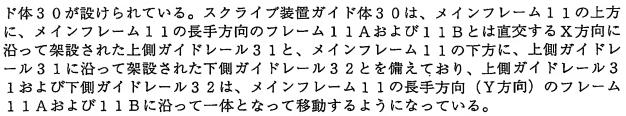
この基板分断システム1は、中空の直方体状の架台10を有しており、架台10の上面には4本の支柱14が設けられ、枠状のメインフレーム11が支柱14の上部に配置されている。該架台10の上面には、搬送ロボットよって本基板分断システム1に搬送される貼り合わせマザー基板90を水平状態で支持する基板支持装置20が配置されている。

#### [0047]

図1に示すように、基板支持装置20は、メインフレーム11内に搬入される貼り合わせマザー基板90を支持するために基板分断システム1の基板搬入側に配置された第1基板支持部20Aと、貼り合わせマザー基板90が分断され、順次、表示パネルが基板分断システムから搬出された後の貼り合わせマザー基板90を支持するために基板搬出側に配置された第2基板支持部20Bとを備えている。なお、架台10における第1基板支持部20A側を基板搬入側、第2基板支持部20B側を基板搬出側とする。

### [0048]

また、図2に示すように、架台10の上方には、基板支持装置20(第1基板支持ユニット21A)によって水平状態で支持された基板を、水平状態で保持するクランプ装置50が設けられている。さらに、図1に示すように架台10の上面には、メインフレーム11の長手方向のフレーム11Aおよび11Bに沿ってスライド可能にスクライプ装置ガイ



### [0049]

図3は、スクライブ装置ガイド体30における上側ガイドレール31近傍の概略斜視図 である。上側ガイドレール31には、上部基板分断装置60が、上側ガイドレール31に 沿って移動可能に取り付けられている。また、図4は、スクライブ装置ガイド体30にお ける下側ガイドレール32近傍の概略斜視図である。下側ガイドレール32には、下部基 板分断装置70が、下側ガイドレール32に沿って移動可能に取り付けられている。

### [0050]

上部基板分断装置60および下部基板分断装置70は、それぞれ、リニアモータによっ て、上側ガイドレール31および下側ガイドレール32に沿って往復移動するようになっ ており、上側ガイドレール31および下側ガイドレール32にそれぞれリニアモータの固 定子が、上部基板分断装置60および下部基板分断装置70にリニアモータの可動子がそ れぞれ取り付けられている。上部基板分断装置60および下部基板分断装置70は、マザ ー基板がクランプ装置 5 0 によって水平状態に保持されるとともに、マザー基板の保持を 補助するための基板支持装置20によって支持された貼り合わせマザー基板90の上側お よび下側の各ガラス基板を複数の表示パネルに分断する。

# [0051]

スクライブ装置ガイド体30における一方の端部には、クランプ装置50によって保持 され、基板支持装置20によって支持された貼り合わせマザー基板90に設けられた第1 のアライメントマークを撮像する第1光学装置38がスクライブ装置ガイド体30に沿っ て移動可能に設けられており、また、スクライブ装置ガイド体30における他方の端部に は貼り合わせマザー基板90に設けられた第2のアライメントマークを撮像する第2光学 装置39がスクライブ装置ガイド体30に沿って移動可能に設けられている。

#### [0052]

架台10の上面に、スクライブ装置ガイド体30を移動させるリニアモータの固定子1 2が、メインフレーム11の長手方向のフレーム11Aおよび11Bに沿ってそれぞれ設 けられている。各固定子12は、それぞれの外側面が開口した扁平な中空直方体形状に形 成され、その断面は、「コ」の字状に形成されている。各固定子の内部には、スクライブ 装置ガイド体30の両端を支持する支柱28を保持するガイドベース15に、リニアモー タの可動子(図示せず)がメインフレーム11の長手方向のフレーム11Aおよび11B に沿ってスライド可能に挿入されている。

#### $[0\ 0\ 5\ 3]$

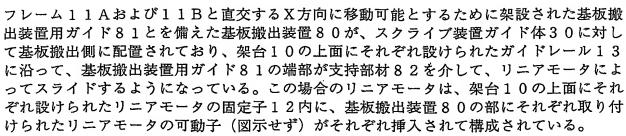
各固定子12には、長手方向に沿って複数の永久磁石がそれぞれ配置されており、隣接 する永久磁石の磁極が相互に反転した状態になっている。各可動子は、それぞれ電磁石に よって構成されており、各可動子を構成する電磁石の磁極を順次切り換えることによって 、各可動子が、各固定子12に沿ってそれぞれスライドする。

### [0054]

図1および図2に示すように、連結板33により上側ガイドレール31および下側ガイ ドレール32の各端面同士を相互に連結されたスクライブ装置ガイド体30の両端が支柱 28により支持され、その支柱28はガイドベース15の上面に保持され、ガイドベース 15にはリニアモータの可動子それぞれ取り付けられている。各可動子は、それぞれ同期 して駆動させられ、各固定子12に沿ってスライドされる。

### [0055]

架台10の搬出側の上方には、貼り合わせマザー基板90から分断された各表示パネル を搬出する搬出ロボット140と搬出ロボット140をメインフレーム11の長手方向の



## [0056]

基板搬出装置80の搬出ロボット140には、貼り合わせマザー基板90から分断された各表示パネルを吸引吸着させる吸着部(図示せず)が設けられており、吸着部によって表示パネルが吸着された状態で、基板搬出装置80全体が、基板搬出側にスライドされることにより、分断された各表示パネルは架台10から搬出される。

図5 (a) は、基板搬出装置80の搬出ロボット140の構成を示す概略構成図である。 搬出ロボット140は基板搬出装置用ガイド81に取り付けられ、リニアモータまたはサ ーボモータの駆動手段と直線ガイドとを組み合わせた移動機構により基板搬出装置用ガイ ド81に沿う方向(X方向)に移動自在となっている。

搬出ロボット140には2個のサーボモータ140aと140mを備えており、サーボモータ140aは駆動シャフト140bと連結している。第1プーリ140cと第2プーリ140eは一体的に取り付けられ、それぞれベアリングを介して駆動シャフト140bに取り付けられ、駆動シャフト140bの回転に対して切り離された状態とされる。アーム140gはその端部が駆動シャフト140bに一体的に取り付けられており、アーム140gは、駆動シャフト140bの回転によって、駆動シャフト140bを中心として回転する。また、アーム140gの先端部には、回転シャフト140gが回転可能に支持されている。回転シャフト140gは、アーム140gを貫通しており、その一方の端部に第3プーリ140hが一体的に取り付けられている。第2プーリ140eと第3プーリ140hとの間には例えば、タイミングベルトのようなベルト141i掛けられる。

### [0057]

さらに、サーボモータ140mの回転軸には第4プーリ140nが取り付けられ、第4プーリ140nと第1プーリ140cとの間が例えば、タイミングベルトのようなベルト140pが掛けられる。これにより、サーボモータ140mの回転はベルト140pを介して第1プーリ140cに伝達され、さらに、ベルト140iを介して第3プーリ140hに伝達され、回転シャフト140gが回転する。

### [0058]

回転シャフト140gの他方の端部には、吸着パッド取り付け板140jの中央部が一体的に取り付けられている。吸着パッド取り付け板140jの下面には、本基板分断システム1で分断された基板を不図示の吸引機構により吸着する吸着パッド140kが設けられている。

## [0059]

このような構成の搬出ロボット140は、サーボモータ140aおよび140mの回転 方向と回転角度を組み合わせて設定することにより、アーム140fの移動距離を最小に して、次工程の装置へ分断された基板の向きを水平の状態で種々角度方向に変えて搬送す ることができる。

尚、分断された基板の搬送において、分断された基板は吸引により吸着パットで保持され、搬出ロボット140全体が昇降機構(不図示)により、一旦上昇した後、次工程の装置へ搬送され、再び、昇降機構(不図示)により搬出ロボット140が下降し、次工程の所定の位置で予め決まられた状態に載置される。

### [0060]

次に、このような構成の搬出ロボット140を用いて分断された基板の向きを例えば90°変化させる場合を図5(b)を用いて説明する。

分断された基板93に、吸着パッド取り付け板140jに取り付けられた各吸着パッド1

40 kが吸着されると、搬出ロボット140全体が昇降機構により上昇し、サーボモータ 140 aが駆動されて、駆動シャフト140 bは基板側から見て時計の針の回転方向とは 逆方向へ90度回転させられる。駆動シャフト140bが90度にわたって回転されると 、アーム140fが、駆動シャフト140bを中心として基板側から見て時計の針の回転 方向とは逆方向へ90度回転する。これにより、アーム140fの先端部に回転シャフト 140gを介して回転可能に支持された吸着パッド取り付け板140;が、アーム140 fともに、駆動シャフト140bを中心として、基板側から見て時計の針の回転方向とは 逆方向へ90度回動する。この場合、吸着パッド取り付け板140jに取り付けられた回 転シャフト140gも駆動シャフト140bを中心に回転移動する。

### [0061]

このとき、サーボモータ140mの回転がベルト140pを介して第1プーリ140c に伝達され、さらに、ベルト140iを介して第3プーリ140hに伝達され、回転シャ フト140gが時計の針の回転方向に180°回転させられる。回転シャフト140gに 取り付けられた吸着パッド取り付け板140jも回転シャフト140gを中心に時計の針 の回転方向に180°回転する。従って、吸着パッド取り付け板140jは、駆動シャフ ト140dを中心として基板側から見て時計の針の回転方向とは逆方向へ90度回動する 間に、回転シャフト140gを中心として基板側から見て時計の針の回転方向へに180 度自転することになる。その結果、各吸着パッド140kにて吸着された分断された基板 93は、図27(b)に示すように、その回転中心位置を移動させながら、比較的小さな スペースで基板側から見て時計の針の回転方向へ90度回転させられる。

### [0062]

基板支持装置20の第1基板支持部20Aおよび第2基板支持部20Bは、例えば、図 1に示すようにそれぞれがスクライブ装置ガイド体30の移動方向と同方向に移動可能に なった5つの第1基板支持ユニット21Aおよび第2基板支持ユニット21Bをそれぞれ 備えている。各第1基板支持ユニット21Aおよび各第2基板支持ユニット21Bは、そ れぞれ、メインフレーム11の長手方向のフレーム11Aおよび11Bに対して平行な方 向(Y方向)に沿った直線状にスクライブ装置ガイド体30の基板搬搬入側および基板搬 出側にそれぞれ配置される。

#### [0063]

図6は、第1基板支持部20Aに設けられた1つの第1基板支持ユニット21Aの側面 図である。第1基板支持ユニット21Aは、架台10の上面に設けられた一対のガイドレ ール13のそれぞれの移動ユニットに保持されたガイドベース15の上面に支柱45設け られ、その支柱45の上方にメインフレーム11のフレーム11Aおよび11Bに沿うY 方向と平行に支持部材43が設けられ、それぞれの支持部材43にメインフレーム11の フレーム11Aと11Bと直交するX方向に架設される2本のユニット取付部材41およ び42に接合部材46および47に取り付けられる。

### [0064]

第1基板支持ユニット21Aは複数台(本実施例の説明においては5台)、所定の間隔 を設けて配置され、スクライブ装置ガイド体30とともにメインフレーム11のフレーム 11Aおよび11Bに沿うY方向へ移動する。

第1基板支持ユニット21Aは、メインフレーム11と平行な方向(Y方向)に沿って直 線状に延びる支持本体部21aを有しており、支持本体部21aの各端部に、例えば、タ イミングベルト21eを案内するタイミングプーリ21cおよび21dがそれぞれ取り付 けられている。タイミングベルト21eは駆動用タイミングプーリ21bが後述するクラ ッチが駆動軸と連結して回転したときに、周回移動させられる。

#### [0065]

このように構成される第1基板ユニット21Aのタイミングベルト21eを移動させる 機構を図7、図8および図9を用いて説明する。図7はスクライブ装置ガイド体30側か ら第1基板支持部20Aに設けられた複数(5台)の第1基板支持ユニット21Aを見た 時の正面図であり、図8はクラッチユニット110の概略構成図、図9はクラッチユニッ



## [0066]

図7に示すように、第1基板ユニット21Aの支持本体部21aに備えられたそれぞれの駆動用タイミングプーリ21bはメインフレーム11の長手方向のフレーム11Aおよび11Bと直交するX方向と平行に設けられた回転駆動シャフト49に結合されている。この回転駆動シャフト49両端はクラッチユニット110へつながり、クラッチユニット110内のクラッチの駆動軸との連結状態によって、回転駆動シャフト49は回転したり、回転しなかったりする。すなわちクラッチユニット内のクラッチが駆動軸122と連結しているときは、回転駆動シャフト49が回転し、駆動軸122と切り離されているときは、回転駆動シャフト49は回転しない。

### [0067]

また、メインフレーム11の長手方向のフレーム11Aおよび11Bの下面にはクラッチユニット110のピニオン111を回転させるラック11aがフレーム11Aおよび1・1Bの長手方向に沿って取り付けられている。

### [0068]

クラッチユニット110のピニオン111は軸123の一方端に結合され、また、軸123の他方端にはタイミングベルト119用のタイミングプーリ112が結合されている

### [0069]

駆動軸122の一方端にはタイミングプーリ115が結合されており、2個のアイドラー113および114を介してタイミングベルト119がタイミングプーリ112とタイミングプーリ115との間に掛けられ、軸123の回転が駆動軸122に伝達される。

## [0070]

駆動軸122の他端には例えばエアークラッチのようなクラッチ116が取り付けられており、クラッチ116内に圧縮空気を投入することにより、駆動軸122と従動軸124は結合され、圧縮空気の投入中断レクラッチ116内の空気圧力を大気圧の状態にすると、駆動軸122と従動軸124との結合は遮断される。

### [0071]

従動軸124のクラッチ116と接合しない側の端部にはタイミングプーリ117が結合されていて、このタイミングプーリ117と第1基板ユニット21Aの支持本体部21aに備えられたそれぞれの駆動用タイミングプーリ21bが結合している回転駆動シャフト49の一方端のタイミングプーリ118との間にはタイミングベルト121が掛けられている。

#### [0072]

図7に示すように、第1基板支持部20Aに設けられた5つの第1基板支持ユニット2 1Aの駆動用タイミングプーリ21bを回転させてタイミングベルト21eを移動させる 機構(クラッチユニット110)は、メインフレーム11の長手方向のフレーム11B側 にも備えられている。

### [0073]

上述したように、5つの第1基板支持ユニット21Aを支持するフレーム11A側の支柱45とフレーム11B側の支柱45がガイドベース15に保持されており、スクライブ装置ガイド体30の両端を支持する支柱28を保持するガイドベース15と一体となって移動するように連結されている。支柱28を保持するガイドベース15にはリニアモータの可動子(図示せず)が取り付けられているため、リニアモータの駆動により、スクライブ装置ガイド体30が基板搬入側へ移動するとともに、第1基板支持部20Aの5台の第1基板支持ユニット21Aが基板搬入側へ移動する。

### [0074]

スクライブ装置ガイド体30が移動する時、フレーム11Aおよび11Bに沿って取り付けられたそれぞれのラック11aとかみ合っているフレーム11A側のクラッチユニット110のピニオン111とフレーム11B側のピニオン111が回転させられる。

# [0075]

尚、第1基板支持ユニット21Aの駆動用タイミングプーリ21bを回転させてタイミングベルト21eを移動させるには、フレーム11Aおよびフレーム11Bの両方のクラッチをそれぞれの駆動軸122と連結させてもよいし、フレーム11Aまたはフレーム11Bのいずれかのクラッチを駆動軸122と連結させてもよい。

## [0076]

基板支持装置20の第2基板支持部20Bは、例えば、それぞれがスクライブ装置ガイド体30の移動方向と同方向に移動可能になった5つの第2基板支持ユニット21Bを備えている。この第2基板支持ユニット21Bは第1基板支持ユニット121Aの構造と同様であり、スクライブ装置ガイド体30に対して対称となるように、Y方向の取付け方向が逆になるように、フレーム11A側の支柱45とフレーム11B側の支柱45に支持され、それぞれの支柱がガイドベース15に保持されている。

## [0077]

5つの第1基板支持ユニット21Aを支持するフレーム11A側の支柱45とフレーム11B側の支柱45がガイドベース15に保持されており、5つの第2基板支持ユニット21Bを支持するフレーム11A側の支柱45とフレーム11B側の支柱45がガイドベース15に保持され、さらに、スクライブ装置ガイド体30の両端を支持する支柱28を保持するガイドベース15と一体となって移動するように連結されている。スクライブ装置ガイド体30の両端を支持する支柱28を保持するガイドベース15にリニアモータの可動子(図示せず)が取り付けられているため、リニアモータの駆動により、スクライブ装置ガイド体30が基板搬入側へ移動するとともに、第1基板支持部20Aの5台の第1基板支持ユニット21Aと第2基板支持部20Bの5台の第2基板支持ユニット21Bが基板搬入側へ移動する。

## [0078]

第2基板支持部20Bのフレーム11A側とフレーム11B側には第1基板支持部120Aと同様のクラッチユニット110が備えられており、スクライブ装置ガイド体30が移動する時、フレーム11Aおよび11Bに沿って取り付けられたそれぞれのラック11aとかみ合っているフレーム11A側のクラッチユニット110のピニオン111とフレーム11B側のピニオン111が回転させられる。

## [0079]

また、第2基板支持ユニット21Bの駆動用タイミングプーリ21bを回転させてタイミングベルト21eを移動させるには、フレーム11Aおよびフレーム11Bの両方のクラッチをそれぞれの駆動軸122と連結させてもよいし、フレーム11Aまたはフレーム11Bのいずれかのクラッチを駆動軸122と連結させてもよい。

### [0080]

図1に示すように、架台10の基板搬出側の上方には、スクライブ加工後完全分断されていない貼り合わせマザー基板90を完全に分断された状態とするためのスチームユニット部160が、第2基板支持部20Bの基板搬出側、基板搬出装置80の基板搬入側に配置される。

### [0081]

スチームユニット部160は貼り合わせマザー基板90の上側のマザー基板に蒸気を吹き付ける複数個のスチームユニット161を取り付ける上側スチームユニット取付けバー162と貼り合わせマザー基板90の下側のマザー基板に蒸気を吹き付ける複数個のスチームユニット161を取り付ける下側スチームユニット取付けバー163がフレーム11A側の支柱164とフレーム11B側の支柱164に、フレーム11Aおよびフレーム11Bとは直交するX方向に沿って取り付けられている。

架台10の上面にそれぞれ設けられたガイドレール13に沿って、フレーム11Aおよび 11B側のそれぞれの支柱164は、リニアモータによってスライドするようになってい る。この場合のリニアモータは、架台10の上面にそれぞれ設けられたリニアモータの固 定子12内に、スチームユニット部160にそれぞれ取り付けられたリニアモータの可動 子(図示せず)がそれぞれ挿入されて構成されている。

### [0082]

図10はスチームユニット部160を基板搬入側から見たときの要部の正面図である。6個のスチームユニット161が上側スチームユニット取付けバー162に取り付けられ、6個のスチームユニット161が上側の6個のスチームユニット161対して間隙GAを開けて下側スチームユニット取付けバー163に取り付けられる。尚間隙GAはスチームユニット部160が基板搬入側へ移動したときに貼り合わせマザー基板90がその間隙GAを通過するように調整される。

### [0083]

図11はスチームユニット161の構造を示す部分側面断面図である。スチームユニット161はそのほぼ全体がアルミ材質で構成されており、鉛直方向に複数本のヒーター161aが埋め込まれている。自動操作で開閉する開閉弁(不図示)が開くと水が水供給口161bからスチームユニット161内に流入し、ヒーター161aで熱せられて、供給された水が気化して蒸気となる。その蒸気が導通孔161cを通って噴出口161dからマザー基板の表面へ向けて吹き付けられる。

### [0084]

また、上側スチームユニット取付けバー162の搬出側には、貼り合わせマザー基板9 0の上面に蒸気が吹き付けられた後、貼り合わせマザー基板90の表面に残った水分を除 去するためのエアーナイフ165が備えられている。

尚、下側スチームユニット取付けバー163にも上側スチームユニット取付けバー162に取り付けられるものと同様のスチームユニット161とエアーナイフ165が備えられる。

### [0085]

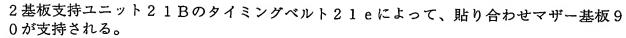
第1基板支持部20Aに貼り合わせマザー基板90が載置され、貼り合わせマザー基板90が位置決めされると、位置決めされた貼り合わせマザー基板90は、クランプ装置50によって保持されるとともに、各第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eによって支持される。

### [0086]

この状態で、まず第1基板支持部20Aと第2基板支持部20Bの4つのクラッチユニット110のクラッチ116が駆動軸122に結合された後、スクライブ装置ガイド体30に設けられた上部基板分断装置60および下部基板分断装置70よって、貼り合わせマザー基板90の分断が開始され、スクライブ装置ガイド体30が基板搬入側へ移動していくのに伴って、第1基板支持部20Aが基板搬入側へスライドされ、さらに第2基板支持部20Bが基板搬入側へとスライドしていく。スクライブ装置ガイド体30が基板搬入側へ移動中、第1基板支持部20Aの第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eと第2基板支持部20Bの第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eは、スクライブ装置ガイド体30の移動速度と同一の速度で周回移動し、貼り合わせマザー基板90を基板搬出方向へ移動させ、分断途中の貼り合わせマザー基板90は第1基板支持部20Aの第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eと第2基板支持部20Bの第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eと第2基板支持さる。

ところが、スクライブ装置ガイド体30の移動中、第1基板支持部20Aの第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eと第2基板支持部20Bの第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eは、スクライブ装置ガイド体30の移動速度と同一の速度でスクライブ装置ガイド体30の移動方向とは逆方向に貼り合わせガラス基板90移動させようとするため、実際には貼り合わせマザー基板90は移動せず、クランプ装置50に保持されたまま、貼り合わせマザー基板90に第1基板支持部20Aの第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eと第2基板支持部20Bの第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eが摺接することなく支持される。

貼り合わせマザー基板90の分断が完了した状態では、第2基板支持部20Bの全ての第



第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eによって、貼り合わせマザー基板90が支持された状態で、スチームユニット部160が基板搬入側へ移動して、スクライプラインが刻まれた貼り合わせマザー基板90の表裏面全体に蒸気を吹きかけて熱応力によって垂直クラックを伸張させて、貼り合わせマザー基板90を完全に分断させるとともに、蒸気を吹きかけた後に貼り合わせマザー基板90の表裏面に残存する水分をエアーナイフ165で除去する。

## [0087]

その後、第2基板支持部20Bの全ての第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21e上の貼り合わせ基板90から分断された全ての表示パネルが、基板搬出装置80の搬出ロボット140によって搬出されることにより、分断された貼り合わせマザー基板90'(端材)が支持される。

## [0088]

そして、基板搬出装置 8 0 およびスチームユニット部 1 6 0 が基板搬出側の端部に移動する。

### [0089]

その後、スクライブ装置ガイド体30、第2基板支持部20Bおよび第1基板支持部20Aが基板搬出側にスライドされる。このとき、第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eと第2基板支持部20Bの第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eは、貼り合わせガラス基板90をスクライブ装置ガイド体30の移動速度と同一の速度で基板搬入方向へあたかも移動させるように周回移動する。

### [0090]

このため、第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eと第2基板支持部20Bの第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eは分断された貼り合わせマザー基板90'の下面から、摺接することなく、順次、非接触状態となり、各タイミングベルト21eによる分断された貼り合わせマザー基板90'の支持が順次解除される。そして、分断された貼り合わせマザー基板90'(端材)は、クランプ装置50による保持が解除され、分断された貼り合わせマザー基板90'(端材)は、下方に落下する。この場合、下方に落下した分断された貼り合わせマザー基板90'(端材及びカレット)は、傾斜状態で配置されたガイド板によって案内されてカレット収容ボックス内に収容されるようになっている。

### [0091]

架台10には、第1基板支持部20Aに支持された貼り合わせマザー基板90を位置決めするための位置決め装置(図示せず)が設けられている。位置決め装置は、例えば複数の位置決めピン(図示せず)が、メインフレーム11のフレーム11Bに沿って、および、そのフレーム11Bに対して直交する方向に沿って、それぞれ一定の間隔をあけて設けられている。また、フレーム11Bに沿って配置された位置決めピンに対して、貼り合わせマザー基板90における各位置決めピンに対向する側縁を押し付けるプッシャー(図示せず)が設けられるとともに、フレーム11Bに対して直交する方向に沿って配置された位置決めピンに対して、貼り合わせマザー基板90における対向する側縁を押し付けるプッシャー(図示せず)が設けられている。

#### [0092]

また、例えば、本発明の基板分断システムに搬送されてくる直前に貼り合わせマザー基板90の位置決めを実施する位置決め装置を本基板分断システムとは別に装備させる場合には、本基板分断システム内の位置決め装置を省略することができる。

### [0093]

また、本基板分断システム内の位置決め装置は、上述の位置決めピンとプッシャーに限定されるものではなく、貼り合わせマザー基板90の基板分断システム内における位置を一定にさせる装置であればよい。

# [0094]

さらに、架台10の上方には、第1基板支持部20Aに支持されて、各位置決めピンに押し付けられて位置決めされた貼り合わせマザー基板90をクランプするクランプ装置50が設けられている。たとえば、クランプ装置50は、図2に示すように、メインフレーム11のフレーム11Bに、位置決めされた貼り合わせマザー基板90におけるそのフレーム11Bに沿った側縁部をクランプするように、長手方向に一定の間隔をあけて取り付けられた複数のクランプ具51と、位置決めされた貼り合わせマザー基板90における基板搬入側の側縁部をクランプするために、各メインフレーム11とは直交する方向に沿って一定の間隔をあけて配置された複数のクランプ具51とを有している。

## [0095]

図12および図13は、メインフレーム11のフレーム11Bに設けられた複数のクランプ具51を示し、その動作を説明するための斜視図である。各クランプ具51は、それぞれ同様の構成になっており、メインフレーム11のフレーム11Bに取り付けられたケーシング51aと、このケーシング51aに、垂直状態から水平状態にわたって回動し得るようにそれぞれ取り付けられた上下一対の回動アーム部51bとを有している。各回動アーム部51bは、それぞれの一方の端部を中心として回動し得るようになっており、それぞれの回動の中心となる端部同士が相互な近接した状態になっている。上側に位置する回動アーム部51bの先端部は、垂直状態では、図12に示すように、回動中心に対して上方に位置し、下側に位置する回動アーム部51bの先端部は、垂直状態では、回動中心に対して下方に位置している。そして、各回動アーム部51bが、貼り合わせマザー基板90側に90度にわたってそれぞれ回動することによって、各回動アーム51bは、それぞれ相互に対向した水平状態になる。

## [0096]

各回動アーム部51bの先端部には、貼り合わせマザー基板90の上面および下面にそれぞれ当接するクランプ部51cがそれぞれ取り付けられている。各クランプ部51cは、それぞれ弾性体によって構成されている。そして、各回動アーム部51bがそれぞれ一体となって垂直状態から水平状態に回動されるとともに、水平状態から垂直状態に回動される。そして、各回動アーム部51bが水平状態に回動されると、各回動アーム部51bの先端部にそれぞれ取り付けられたクランプ部51cによって、図13に示すように、貼り合わせマザー基板90がクランプされる。

#### [0097]

メインフレーム11のフレーム11Bと直交する方向に沿って配置された各クランプ具51も、それぞれ同様の構成になっており、これらのクランプ具51も一体となって駆動される。貼り合わせマザー基板90は、相互に直交する各側縁部が、それぞれ複数のクランプ具51にてクランプされた状態になると、全てのクランプ具51が下方へ沈み込み、第1基板支持部20Aのタイミングベルト21eによって支持される。

#### [0098]

また、上記したクランプ装置50の配置は、貼り合わせマザー基板90を保持するクランプ装置50をメインフレーム11のフレーム11Bとフレーム11B直交する方向の基板搬入側に備える場合を説明したが、フレーム11Bにのみクランプ装置50を備える場合であっても、貼り合わせマザー基板90は基板に損傷を与えることなく保持できる。

## [0099]

上記のクランプ装置 5 0 およびクランプ具 5 1 の構成は本発明の基板分断システムに用いられる一例を示したものであり、これに限定されるものではない。すなわち、貼り合わせマザー基板 9 0 における側縁部を把持または保持する構成のものであればよい。また、例えば基板サイズが小さい場合には、基板の側縁部の 1 箇所をクランプすることにより基板が保持され、基板に不具合を生じさせることなく基板を分断することができる。

#### [0100]

スクライブ装置ガイド体30における上側ガイドレール31には、図3に示すように、 上部基板分断装置60が取り付けられており、また、下側ガイドレール32には、図4に 示すように、上部基板分断装置60と同様の構成であって、上下を反転した状態の下部基板分断装置70が取り付けられている。上部基板分断装置60および下部基板分断装置70は、前述したように、それぞれ、リニアモータによって、上側ガイドレール31および下側ガイドレール32に沿ってスライドするようになっている。

## [0101]

例えば、上部基板分断装置60及び下部基板分断装置70には、貼り合わせマザー基板90の上部ガラス基板をスクライブするカッターホイール62aがチップホルダ62bに回転自在に取り付けられており、さらに、チップホルダ62bはクランプ装置50によって保持された貼り合わせマザー基板90の表面に対して垂直方向を軸として回転自在にカッターヘッド62cに取り付けられている。そして、カッターヘッド62cは図示しない駆動手段により貼り合わせマザー基板90の表面に対して垂直方向に沿って移動自在になっており、カッターホイール62aには、図示しない付勢手段により適宜、荷重がかけられるようになっている。

## [0102]

チップホルダ62bに保持されたカッターホイール62aとしては、例えば、特開平9-188534号公報に開示されているように、幅方向の中央部が鈍角のV字状になるように突出した刃先を有しており、その刃先に、所定の高さの突起が周方向に所定のピッチで形成されているものが用いられる。

## [0103]

下側ガイドレール32に設けられた下部基板分断装置70は、上部基板分断装置60と同様の構成になっており、上部基板分断装置60とは上下を反転した状態で、そのカッターホイール62a(図4参照)が、上部基板分断装置60のカッターホイール62aと対向するように配置されている。

## [0104]

上部基板分断装置 6 0 のカッターホイール 6 2 a は、上述した付勢手段とカッターヘッド 6 2 c の移動手段とにより、貼り合わせマザー基板 9 0 の表面に圧接され、下部基板分断装置 7 0 のカッターホイール 6 2 a も、上述の付勢手段とカッターヘッド 6 2 c の移動手段とにより、貼り合わせマザー基板 9 0 の裏面に圧接される。そして、上部基板分断装置 6 0 と下部基板分断装置 7 0 とを同時に同一の方向へ移動させることにより、貼り合わせマザー基板 9 0 は分断されていく。

## [0105]

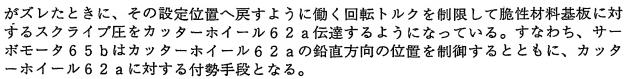
このカッターホイール62 a はWO 03/011777に開示されているサーボモータを用いたカッターヘッド65に回転自在に支持されることが望ましい。

サーボモータを用いたカッターヘッド65の一例として、図14は、カッターヘッド65の側面図を示し、図15にその主要部の正面図を示す。一対の側壁65a間にサーボモータ65bが倒立状態で保持され、その側壁65aの下部には、側方から見てL字状のホルダー保持具65cが支軸65dを通じて回動自在に設けられている。そのホルダー保持具65cの前方(図15中、右方向)には、軸65eを介してカッターホイール62aを回転自在に支持するチップホルダ62bが取り付けられている。サーボモータ65bの回転軸と支軸65dとには、平傘歯車65fが互いにかみ合うように装着されている。これにより、サーボモータ65bに正逆回転により、ホルダー保持具65cは支軸65dを支点として俯仰動作を行ない、カッターホイール62aが上下動する。このカッターヘッド65自体は、上部基板分断装置60と下部基板分断装置70に備えられる。

#### [0106]

図16はサーボモータを用いたカッターヘッドの別の一例を示す正面図であり、サーボモータ65bの回転軸をホルダー具65cに直結したものである。

図14及び図16のカッターヘッドはサーボモータを位置制御により回転させることで、カッターホイール62aを昇降させて位置決めする。これらのカッターヘッドはカッターヘッドを水平方向へ移動させて貼り合わせマザー基板90にスクライブラインを形成するスクライブ動作中に、予めサーボモータ65b設定されたカッターホイール62aの位置



## [0107]

上述したサーボモータを備えたカッターヘッドを用いることで、貼り合わせマザー基板 90をスクライブする時に、カッターホイール62aが受ける抵抗力の変動によるスクライブ圧の変化に瞬時に対応してサーボモータの回転トルクが修正されるため、安定したスクライブが実施でき、品質のよいスクライブラインを形成することができる。

### [0108]

尚、貼り合わせマザー基板90をスクライブするダイヤモンドポイントカッターやカッターホイールなどのスクライブカッターを振動させて、スクライブカッターによる貼り合わせマザー基板90への押圧力を周期的に変化させる機構を備えるカッターヘッドも本発明の基板分断システムのマザー基板の分断に有効に適用される。

### [0109]

尚上部基板分断装置 6 0 及び下部基板分断装置 7 0 は上記の構成に限るものではない。 すなわち、基板の表裏面を加工して基板を分断させる構成の装置であればよい。

### [0110]

例えば、上部基板分断装置60及び下部基板分断装置70がレーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、切断刃 ダイヤモンドカッター等を用いてマザー基板を分断させる 装置であってもよい。

### [0111]

マザー基板が、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板、およびセラミックス基板、ガラス基板、半導体基板等の脆性材料基板である場合には、例えばレーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、切断刃 ダイヤモンドカッター等を用いてマザー基板を分断する基板分断装置が用いられる。

### [0112]

さらに、一対のマザー基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板、異なるマザー基板を 組み合わせて貼り合わせた貼り合わせマザー基板、複数のマザー基板同士を組み合わせて 積層させた基板を分断する場合にも上述のマザー基板を分断するものと同様の基板分断装 置が用いられる。

### [0113]

また、上部基板分断装置60及び下部基板分断装置70には基板の分断を補助する分断補助手段を備えていてもよい。分断補助手段としては、例えば、ローラなどを基板に押圧させたり、圧縮空気を基板に向けて噴射させたり、レーザを基板に照射するか、熱風などを基板に吹きかけて基板を温める(熱する)ものが一例として挙げられる。

#### [0114]

さらに、上述の説明においては、上部基板分断装置60及び下部基板分断装置70が同一の構成である場合を説明したが、基板の分断パターンや基板の分断条件により異なる構成の装置であってもよい。

#### [0115]

このような構成の基板分断システムの動作について、大判のガラス板を貼り合わせた貼り合わせ基板を分断する場合の一例を主に説明する。

## [0116]

大判のガラス基板が相互に貼り合わせられた貼り合わせマザー基板 9 0 を、複数の表示パネル 9 0 a (図 1 8 参照) に分断する際には、まず、図 1 7 に示すように、基板搬入側の端部から、搬送ロボット等によって本基板分断システムに搬入されて、第 1 基板支持部 2 0 A の全ての第 1 基板支持ユニット 2 1 A のタイミングベルト 2 1 e に貼り合わせマザー基板 9 0 を水平状態で載置する。

### [0117]

このような状態になると、貼り合わせマザー基板90は、メインフレーム11のフレーム11Bに沿って配置された図示しない位置決めピンに当接するように、図示しないプッシャーによって押圧されるとともに、そのフレーム11Bとは直交する方向に沿って配置された図示しない位置決めピンに当接するように、図示しないプッシャーによって押圧される。これにより、貼り合わせマザー基板90は、基板分断システムにおける架台10内の所定の位置に位置決めされる。

## [0118]

その後、図17に示すように貼り合わせマザー基板90は、クランプ装置50の各クランプ具51によって、メインフレーム11のフレーム11Bに沿った側縁部がそれぞれクランプされるとともに、基板搬入側にフレーム11Bとは直交するように配置された各クランプ具51によって、基板搬入側に位置する貼り合わせマザー基板90の側縁部がクランプされる。

## [0119]

貼り合わせマザー基板90の相互に直交する各側縁部がそれぞれクランプ装置50によってクランプされると、貼り合わせマザー基板90の側縁部をクランプしている各クランプ具51が貼り合わせマザー基板90の自重によりほぼ同時に沈み込むため、貼り合わせマザー基板90が全ての第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eによって補助的に支持された状態とされる。

### [0120]

このような状態になると、第1基板支持部20Aと第2基板支持部20Bの4つのクラッチユニット110のクラッチ116が駆動軸122に結合された後、スクライブ装置ガイド体30が、クランプ装置50によって水平状態にクランプされた貼り合わせマザー基板90における近接した側縁部上の所定位置になるように、基板搬入側にスライドされる。そして、スクライブ装置ガイド体30に設けられた第1光学装置38および第2光学装置39がそれぞれの待機位置からスクライブ装置ガイド体30に沿って移動することにより、それぞれ貼り合わせマザー基板90に設けられた第1アライメントマークと第2アライメントマークを撮像する。

### [0121]

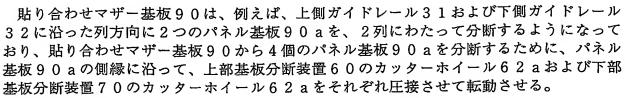
スクライブ装置ガイド体30がスライドすることにより、第1基板支持部20Aが、基板搬入側にスライドされ、第2基板支持部20Bが基板搬入側へスライドされるととともに、第1基板支持部20Aの第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eと第2基板支持部20Bの第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eが、貼り合わせマザー基板90をスクライブ装置ガイド体30の移動速度と同一の速度でスクライブ装置ガイド体30の移動方向とは逆方向に貼り合わせガラス基板90移動させるため貼り合わせマザー基板90は、クランプ装置50に保持されたまま、貼り合わせマザー基板90に第1基板支持部20Aの第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eと第2基板支持部20Bの第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eが摺接することなく支持される。

#### [0122]

次に、第1アライメントマークと第2アライメントマークの撮像結果に基づいて、図示しない演算処理装置によりクランプ装置50によって水平状態で支持された貼り合わせマザー基板90のスクライブ装置ガイド体30に沿った方向に対する傾き、分断開始位置と分断終了位置を演算によって求め、その演算結果に基づいて、上部基板分断装置60および下部基板分断装置70とともに、スクライブ装置ガイド体30も移動させて貼り合わせマザー基板90を分断する。(これを直線補間によるスクライブあるいは分断と呼ぶ)

この場合、図18に示すように、貼り合わせマザー基板90の表面および裏面にそれぞれ対向したカッターホイール62aを、各表面および裏面にそれぞれ圧接して転動させることにより、貼り合わせマザー基板90の表面および裏面にスクライブラインが形成される。

### [0123]



## [0124]

この場合、上部基板分断装置60のカッターホイール62aと、下部基板分断装置70のカッターホイール62aにより、各ガラス基板における各カッターホイール62aの転接部分にそれぞれ垂直クラックが生成されてスクライブライン95が形成される。しかも、各カッターホイール62aの刃先には、外周稜線に所定のピッチで突起部がそれぞれ形成されているために、各ガラス基板には、厚さ方向にガラス基板の厚さの約90%の長さの垂直クラックが形成される。

## [0125]

また、貼り合わせマザー基板90をスクライブするダイヤモンドポイントカッターやカッターホイールなどのスクライブカッターをスクライブカッターによる貼り合わせマザー基板90への押圧力を周期的に変化(振動)させる機構を備えるカッターヘッドを用いるスクライブ方法も本発明の基板分断システムの貼り合わせマザー基板90の分断に有効に適用される。

## [0126]

貼り合わせマザー基板90の表裏面をスクライブする方法としては、図19のように貼り合わせマザー基板90の短辺方向である縦方向に沿ってスクライブ定ラインS1~S4に沿って、順番にスクライブラインを形成した後に、長辺方向である横方向に沿ったスクライブ予定ラインS5からS8に沿って順番にスクライブラインを形成する従来の方法が一般的に用いられる。

# [0127]

また、上述のスクライブ方法の他に本発明の基板分断システムには図20に示すスクライブ方法を好適に実施することができる。図20では、1枚の貼り合わせマザ基板90から4枚のパネル基板90aを形成するようになっている。

## [0128]

貼り合わせマザー基板90は、長方形状になっており、4枚のパネル基板90aは、貼り合わせマザー基板90の長手方向に沿って2枚のパネル基板90aが形成されるとともに、長手方向と直交する幅方向に沿って2枚のパネル基板90aが形成される。各パネル基板90aは、隣接するパネル基板90aとは適当な間隔をあけた状態で、また、貼り合わせマザー基板90の長手方向に沿った各側縁および幅方向に沿った各側縁ともそれぞれ適当な間隔をあけて形成される。

#### [0129]

上部基板分断装置60のカッターホイール62aおよび下部基板分断装置70のカッターホイール62aをそれぞれ対向させて、同時に圧接転動させることにより、パネル基板90aを1枚ずつ、順番に、全周にわたるスクライブラインを貼り合わせマザー基板90の表裏面に形成する。

## [0130]

この場合、まず、スクライブの対象となるパネル基板90aに対して、貼り合わせマザー基板90の長手方向と平行な側縁に沿った1本の直線状のスクライブ予定ラインS1に沿ってスクライプラインを形成する。すなわち、カッターヘッド62cのカッターホイール62aを、このスクライブ予定ラインS1に沿って貼り合わせマザー基板90の表裏面に圧接転動させる。

## [0131]

このとき、図21において、カッターホイール62aによるスクライブ開始点は貼り合わせマザー基板90上の位置(内切りの位置)となっているが、スクライブ予定ラインS1に沿った貼り合わせマザー基板90の端面の外側近傍の位置(外切りの位置)であって



# [0132]

スクライブ予定ラインS1に沿って、厚さ方向の全体にわたる垂直クラックによるスクライブラインが形成されると、スクライブ装置ガイド体30をY方向へかつ上部基板分断装置60および下部基板分断装置70をX方向へ同時に移動させることによって、カッターホイール62aが半径1mm程度の円形状の軌跡が形成されるように垂直軸回りに270度にわたって旋回させられる(図21のコーナー部A)。

## [0133]

カッターホイール 6 2 a が旋回移動中は、貼り合わせマザー基板 9 0 に対するカッターホイール 6 2 a の圧接力が低減するため、貼り合わせマザー基板 9 0 には深い垂直クラックが形成されない。貼り合わせ基板 9 0 の板厚が 0. 7 mmのときカッターホイール 6 2 a が旋回移動中に貼り合わせマザー基板 9 0 に形成する垂直クラックの深さは 1 0 0  $\mu$  m  $\sim$  2 0 0  $\mu$  m 程度である。

## [0134]

図19のように、カッターホイール62aによりクロススクライブする際には、第1の方向にスクライブし、第2の方向へスクライブしたときに形成されたスクライブラインの交点で、貼り合わせマザー基板90に欠けが発生しやすい。

## [0135]

このような欠けは、既に第1の方向へスクライブした時に、貼り合わせマザー基板90にほぼその板厚に達するような垂直クラックが形成されているため、第2の方向へのスクライブ中にカッターホイール62aが第1の方向のスクライブライン付近に達すると、第1のスクライブラインの手前側でマザーガラス基板90が沈みこみ、第1の方向のスクライブラインと第2の方向のスクライブラインの交差部で第1の方向のスクライブラインに沿ったガラス基板に乗り上げるときに発生する。

## [0136]

図20に示すようなスクライブ方法においてはカッターホイール62aを旋回させて、 貼り合わせマザー基板90に対する圧接力を低減させて、既に形成されたスクライブ予定 ラインS1に沿ったスクライブラインと交差させるため、スクラブラインが交差する前に 貼り合わせマザー基板90の一部分が沈み込むことがなく、スクライブラインが交差する ときの貼り合わせマザー基板90の欠けの発生を防ぐことができる。

#### [0137]

カッターホイール62aの進行方向が270度にわたって旋回されて、カッターホイール62aが、スクライブ予定ラインS1と直交するパネル基板90aの幅方向に沿った直線状のスクライブ予定ラインS2に沿った状態になると、スクライブ予定ラインS2に沿ってカッターホイール62aが圧接転動させられる。これにより、スクライブ予定ラインS2に沿って、厚さ方向の全体にわたる垂直クラックによるスクライブラインが形成される。

## [0138]

その後、同様にして、カッターホイール62aを貼り合わせマザー基板90の表裏面から離間させることなく、コーナー部Bにおいて、半径1mm程度の円形状の軌跡を形成しつつスクライプ予定ラインS2とは直交する方向に270度にわたって旋回させて、スクライプ予定ラインS3に沿った状態として、スクライプ予定ラインS3に沿った状態として、スクライプラインを形成する。さらにその後に、同様にして、カッターホイール62aを貼り合わせガラス基板90の表裏面から離間させることなく、コーナー部Cにおいて、半径1mm程度の円形状の軌跡を形成しつつスクライプ予定ラインS3とは直交する方向に270度にわたって旋回させて、スクライプ予定ラインS4に沿った状態として、スクライプ予定ラインS4に沿った状態として、スクライプラ定ラインS4に沿った状態として、スクライプラにある。

### [0139]

これにより、パネル基板90aの周囲には、4本の直線状のスクライブラインによる閉曲線が形成された状態になる。その後、例えば、貼り合わせマザー基板90の長手方向に隣接するパネル基板90aを形成するために、同様にして、そのパネル基板90aの周囲に、4本の直線状のスクライブラインによる閉曲線を全周にわたって形成し、さらには、残りの一対のパネル基板90aのそれぞれに対しても、順番に4本の直線状のスクライブラインによる閉曲線を全周にわたって形成する。

さらに、上述のスクライブ方法の他に本発明の基板分断システムでは、図21に示すスクライブ方法を好適に実施することができる。図21では、1枚の貼り合わせマザー基板90から4枚のパネル基板90aを形成するようになっている。

### [0140]

図21に示すスクライプ方法では、パネル基板90aにおける相互に直交するスクライプ予定ラインS1およびS2に沿ったスクライブラインを、前述と同様の方法によって形成する。スクライブ予定ラインS1に沿ってスクライブラインを形成する場合には、カッターホイール62aを、貼り合わせマザー基板90の端面の外側付近に位置させて、そこから連続的にスクライブ予定ラインS1に沿ったスクライブラインを形成する。

## [0141]

スクライブ開始当初において、カッターホイール62aが貼り合わせマザー基板90の表裏面に乗り上げるときに発生する貼り合わせマザー基板90の欠けは、製品となるパネル基板90aには影響しない。

## [0142]

そして、コーナー部Aにおいて、円形状の軌跡を形成しつつスクライブ予定ラインS1とは直交する方向に270度にわたって旋回させて、スクライブ予定ラインS2に沿った状態として、スクライブ予定ラインS2に沿って、ほぼ厚さ方向の全体にわたる垂直クラックによるスクライブラインを形成する。

### [0143]

その後、カッターホイール62aを、一旦、貼り合わせマザー基板90の表面から離間した後に、スクライブ予定ラインS1とは直交する方向のスクライプ予定ラインS4およびS3に沿ったスクライブラインを、その順番で形成する。この場合も、スクライブ開始当初において、カッターホイール62aが貼り合わせマザー基板90の表裏面に乗り上げるときに発生する貼り合わせマザー基板90の欠けは、製品となるパネル基板90aには影響しない。

### [0144]

これにより、パネル基板90aの周囲には、4本の直線状のスクライブラインが形成された状態になる。その後、例えば、貼り合わせマザー基板90の長手方向に隣接するパネル基板90aを形成するために、同様にして、そのパネル基板90aの周囲に、4本の直線状のスクライブラインを全周にわたって形成し、さらには、残りの一対のパネル基板90aのそれぞれに対しても、順番に、4本の直線状のスクライブラインによる閉曲線を全周にわたって形成する。

上述のスクライブ方法で貼り合わせマザー基板にスクライブラインを形成した後、図22に示すように、第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eによって、スクライプライン95が形成されたマザー貼り合わせ基板90が支持された状態で、スチームユニット部160が基板搬入側へ移動して、スクライブラインが刻まれた貼り合わせマザー基板90の表裏面全体に蒸気を吹きかけて、貼り合わせマザー基板90が完全に分断させるとともに、蒸気を吹きかけた後の貼り合わせマザー基板90の表裏面に残存する水分をエアーナイフ165で除去する。

スクライブラインが刻まれた貼り合わせマザー基板90の表裏面全体に蒸気を吹きかけることにより、カッターホイール62aによって形成されたスクライブラインは、貼り合わせマザー基板90の表裏面部分が加熱されて体積膨張することによって、垂直クラックは、貼り合わせマザー基板90の上下のマザー基板の表面から貼り合わせ面側に伸展し、貼り合わせマザー基板90が完全に分断される。

## [0145]

その後、図22に示すように、第2基板支持部20Bの全ての第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21e上の貼り合わせ基板90から分断された全てのパネル基板90aが、基板搬出装置80の搬出ロボット140によって搬出されることにより、分断された貼り合わせマザー基板90'(端材)が支持される。

### [0146]

そして、基板搬出装置80およびスチームユニット部160が基板搬出側の端部に移動する。

# [0147]

その後、図23に示すように、スクライブ装置ガイド体30、第2基板支持部20Bおよび第1基板支持部20Aが基板搬出側にスライドされる。このとき、第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eと第2基板支持部20Bの第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eは、貼り合わせガラス基板90をスクライブ装置ガイド体30の移動速度と同一の速度で基板搬入方向へあたかも移動させるように周回移動する。

### [0148]

このため、第1基板支持ユニット21Aのタイミングベルト21eと第2基板支持部20Bの第2基板支持ユニット21Bのタイミングベルト21eは分断された貼り合わせマザー基板90°の下面と摺接することなく、順次、非接触状態となり、各タイミングベルト21eによる分断された貼り合わせマザー基板90°の支持が順次解除される。そして、分断された貼り合わせマザー基板90°(端材)は、クランプ装置50による保持が解除され、分断された貼り合わせマザー基板90°(端材)は下方に落下する。この場合、下方に落下した分断された貼り合わせマザー基板90°(端材及びカレット)は、傾斜状態で配置されたガイド板によって案内されてカレット収容ボックス内に収容されるようになっている。

# [0149]

尚、スクライブ装置ガイド体30の上部基板分断装置60および下部基板分断装置70によるスクライブ方法に以下に説明するスクライブ方法を用いることにより、スチームユニット部160による貼り合わせ基板の分断工程を省略することができる。この場合、図24に示すように、貼り合わせマザー基板90の上部のマザー基板91および下部マザー基板92の分断予定ラインに沿って、カッターホイール62aがマザー基板91および92に圧接させられ、転動させられて、マザー基板91および92をスクライブする。これにより、マザー基板91および92のそれぞれの厚さ方向に沿った垂直クラックVmが、分断予定ラインに沿って順次形成され、主スクライブラインMSが形成される。垂直クラックVmは、マザー基板91および92の表面から、マザー基板91および92のそれぞれの厚さの80%以上に達するように、さらに好ましくは90%以上に達するように形成される。

### [0150]

その後、マザー基板91および92を分断することによって得られるパネル基板の領域外において、主スクライブラインMSに対して、0.5~1.0mm程度の間隔をあけて、主スクライブラインMSに沿って、カッターホイール62aをマザー基板91および92に圧接転動させることによってマザー基板91および92をスクライブする。これにより、マザー基板91および92の厚さ方向に沿った垂直クラックVsが、主スクライブラインMSに沿って、順次形成されて、補助スクライブラインSSが形成される。

#### [0151]

このとき、カッターホイール62aがマザー基板91および92の表面を圧接転動して、その刃部がマザー基板91および92の表面に食い込むことによって、マザー基板91および92の表面部分には圧縮力が加わり、すでに形成されている主スクライプラインMSにおける垂直クラックVmの表面部分に圧縮力が作用する。この場合、主スクライプラインMSを形成する垂直クラックVmは、マザー基板91および92のそれぞれの厚さに対して、80%以上に達するように形成されており、マザー基板91および92の表面部

分が圧縮されることにより、主スクライブラインMSの垂直クラックVmは、マザー基板 9 1 および 9 2 の表面部分における間隙が圧縮された状態になり、底面部分での間隔を広 げる状態となるため、垂直クラックVmは、マザー基板 9 1 および 9 2 の貼り合わせ面に向かって伸展する。この垂直クラックVmがマザー基板 9 1 および 9 2 の貼り合わせ面に達し、主スクライブラインMSの全体にわたって、垂直クラックVmが、マザー基板 9 1 および 9 2 の貼り合わせ面に達した状態になることにより、貼り合わせマザー基板 9 0 は、主スクライブラインMSに沿って分断される。

## [0152]

補助スクライプラインSSは、主スクライブラインMSに対して、 $0.5\,\mathrm{mm}\sim1.0\,\mathrm{mm}$ 程度の間隔をあけて形成することが好ましい。主スクライブラインMSに対する補助スクライブラインSSの間隔が $0.5\,\mathrm{mm}$ よりも小さい場合には、主スクライブラインMSを形成する垂直クラック $V\,\mathrm{mo}$ 表面側部分に対して大きな圧縮力が作用し、垂直クラック $V\,\mathrm{mo}$ 表面側端部に欠け等の損傷が生じるおそれがある。反対に、その間隔が $1.0\,\mathrm{m}$  mよりも大きくなると、主スクライブラインMSの垂直クラック $V\,\mathrm{mo}$ に作用する圧縮力が十分ではなく、垂直クラック $V\,\mathrm{mo}$ が、マザー基板 $1\,\mathrm{short}$ 1 および $1\,\mathrm{short}$ 2 の貼り合わせ面にまで達しないおそれがある。

### [0153]

上述のように、主スクライプラインMSと補助スクライプラインSSの二重のスクライブラインを所定の間隔で形成することにより、貼り合わせマザー基板90から複数の表示パネルが分断される。

### [0154]

図25はこのような主スクライブラインMSと補助スクライブラインSSの二重のスクライブラインを用いて貼り合わせマザー基板90からパネル基板90aを分断するスクライブパターンを説明する図である。上部基板分断装置60および下部基板分断装置70のそれぞれのカッターホイール62aが、貼り合わせマザー基板90における基板搬出側の2つのパネル基板90aの基板搬出側の側縁に沿った状態とされ、二重のスクライブライン(主スクライブラインMS1と補助スクライブラインSS1)が2つのパネル基板90aの基板搬出側の側縁に沿って形成される。

### [0155]

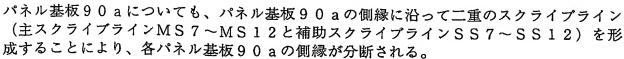
その後、貼り合わせマザー基板90における基板搬出側の2つのパネル基板90aにおける基板搬入側の各側縁に沿って主スクライブラインMS2と補助スクライブラインSS2が形成される。貼り合わせマザー基板90における基板搬出側の2つのパネル基板90aにおける基板搬出側および基板搬入側の各側縁が分断された状態になると、各カッターホイール62aが、貼り合わせマザー基板90の基板搬出側に位置する側縁部上に位置するように、スクライブ装置ガイド体30が基板搬出側にスライドされる。そして、上部基板分断装置60および下部基板分断装置70のカッターホイール62aが、メインフレーム11のフレーム11Aに近接する基板搬出側のパネル基板90aにおけるそのメインフレーム11に近接した側縁の延長線上に位置するように、上部基板分断装置60および下部基板分断装置70が、上側ガイドレール31および下側ガイドレール32に沿ってスライドされる。そして、その側縁の延長線上に沿って、二重のスクライプライン(主スクライブラインMS3と補助スクライブラインSS3)が形成され、メインフレーム11のフレーム11Aに近接する基板搬出側のパネル基板90aにおけるそのフレーム11Aに近接した側縁が分断された状態になる。

### [0156]

以後、同様にして、フレーム11Aと平行に二重のスクライブライン(主スクライブラインMS4~MS6と補助スクライブラインSS4~SS6)をそれぞれ形成することにより、基板搬出側に位置する各パネル基板90aのフレーム11Aに沿った方向の側縁をそれぞれ分断する。

#### [0157]

その後、上側ガイドレール31および下側ガイドレール32に沿った他の2列の2つの



# [0158]

上述の説明においては、二重のスクライブラインを、それぞれ個別に形成する場合を一例として説明したが、この方法に限定されるものではない。すなわち、各パネル90aの側縁に沿って二重のスクライブラインが形成されていればよく、例えば、一本のスクライブラインで各パネル基板90aの側縁において二重のスクライブラインを形成してもよい

## [0159]

図26は、主スクライブラインMSと補助スクライブラインSSの二重のスクライブラインを用いて貼り合わせマザー基板90からパネル基板90aを分断するスクライブパターンを説明する平面図である。この例では、貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92は、第1~第8の分断予定ラインD1~D8に沿って、その順番に分断されることによって、2行×2列の4つのパネル基板90aとされる。

### [0160]

第1分断予定ラインD1は、第1行の2つのパネル基板90aにおける行方向(横方向)に沿った側縁に対応しており、貼り合わせマザー基板90の行方向に沿った一方の側縁に対して一定の間隔が設けられている。第2分断予定ラインD2は、第1行の2つの分断基板90aにおける第2行のパネル基板90aに近接した側縁に対応している。第3分断予定ラインD3は、第2行の2つのパネル基板90aにおける第1行のパネル基板90aに近接した側縁に対応しており、第2分断予定ラインD2とは、2~4mmの間隔があけられている。第4分断予定ラインD4は、第2行の2つのパネル基板90aにおける行方向(横方向)に沿った側縁に対応しており、貼り合わせマザー基板90の行方向に沿った他方の側縁に対して一定の間隔が設けられている。

## [0161]

第5分断予定ラインD 5 は、第1列の2つのパネル基板90aにおける列方向(縦方向)に沿った側縁に対応しており、貼り合わせマザー基板90の列方向に沿った一方の側縁に対して一定の間隔が設けられている。第6分断予定ラインD 6 は、第1列の2つのパネル基板90aにおける第2列のパネル基板90aに近接した側縁に対応している。第7分断予定ラインD 7 は、第2列の2つのパネル基板90aにおける第1列のパネル基板90aに近接した側縁に対応しており、第6分断予定ラインD 6 とは、 $2\sim4$  mmの間隔が開けられている。第8分断予定ラインD 8 は、第2列の2つのパネル基板90aにおける列方向(縦方向)に沿った側縁に対応しており、貼り合わせマザー基板90の列方向に沿った他方の側縁に対して一定の間隔が設けられている。

#### [0162]

このような貼り合わせマザー基板 9.0 を分断する際には、まず、貼り合わせマザー基板 9.0 に対して、例えば、カッターホイール 6.2 a を、第 1 ~第 4 分断予定ライン D.1 ~ D.4 に沿って、その順番で、圧接状態で転動させる。これにより、貼り合わせマザー基板 9.0 の上下のマザー基板 9.1 および 9.2 の表面からマザー基板 9.1 および 9.2 のそれぞれの 厚みの 9.0 %以上の深さの垂直クラックによる第 1 ~第 4 の主クライブライン MS.1.6 がそれぞれ形成される。

### [0 1 6 3]

このような状態になると、第5分断予定ラインD5に沿って、カッターホイール62aを圧接状態で転動させる。これにより、第5の分断予定ラインD5に沿って、第5の主スクライプラインMS17がそれぞれ形成される。

## [0164]

以後、同様にして、第6~第8分断予定ラインD6~D8に沿って、カッターホイール62aを、順番に、圧接状態で転動させて、第6~第8の分断予定ラインD6~D8に沿って、第6~第8の主スクライプラインMS18~MS20を、その順番で、それぞれ形

成する。

## [0165]

このようにして、第1~第8の主スクライプラインMS13~MS20が形成されると、第1の主スクライプラインMS13に対してパネル基板90aとは反対側の貼り合わせマザー基板90の側縁部において、第1の主スクライブラインMS13に対して0.5~1.0mm程度の間隔をあけて、カッターホイール62aを圧接状態で転動させることによって、第1の補助スクライプラインSS13を第1の主スクライプラインMS13に沿って形成する。これにより、第1の主スクライプラインMS13における垂直クラックが、貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92の貼り合わせ面に向かって伸展し、マザー基板91および92の貼り合わせ面に達する。この作用が第1の主スクライプラインMS13の全体にわたり起こることによって、第1の主スクライブラインMS13に沿って貼り合わせマザー基板90が分断される。

## [0166]

次に、第2の主スクライブラインMS14に対してパネル基板90aとは反対側の領域に、第2の主スクライブラインMS14に対して0.5~1.0mm程度の間隔をあけて、カッターホイール62aによって、第2の補助スクライブラインSS14を第2の主スクライプラインMS14に沿って形成する。これにより、第2の主スクライブラインMS14における垂直クラックが、貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92の貼り合わせ面に達するように伸展し、第2の主スクライブラインMS14の全体にわたって垂直クラックがマザー基板91および92の貼り合わせ面に達することによって、貼り合わせマザー基板90が第2の主スクライプラインMS14に沿って分断される。

## [0167]

第3の主スクライブラインMS15および第4の主スクライブラインMS16に沿って、パネル基板90a側とは反対側に第3の補助スクライブラインSS15および第4の補助スクライブラインSS16をそれぞれ形成することにより、第3の主スクライブラインMS15および第4の主スクライブラインMS16に沿って、貼り合わせマザー基板90が順次分断される。

## [0168]

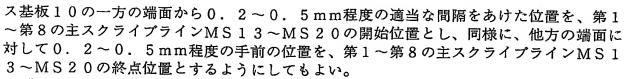
その後、第5の主スクライブラインMS17~第8の主スクライブラインMS20に沿って、パネル基板90a側とは反対側に第5の補助スクライブラインSS17~第8の補助スクライブラインSS20を第1の主スクライブラインMS13と第2の主スクライブラインMS14との間、第3の主スクライブラインMS15と第4の主スクライブラインMS16との間にそれぞれ形成することにより、第5の主スクライブラインMS17~第8の主スクライブラインMS20に沿って、貼り合わせマザー基板90が分断され、不要部分が除去されて4つのパネル基板90aが得られる。

## [0169]

なお、この場合には、第1~第8の主スクライブラインMS13~MS20は、貼り合わせマザー基板90の端面間、すなわち、貼り合わせマザー基板90の一方の端面から対向する他方の端面にわたって形成された分断予定ラインD1~D8の全体にわたって形成されており、また、第1~第8の補助スクライブラインSS13~SS20は、貼り合わせマザー基板90の端面または分断された一方の分断面から対向する他方の端面または他方の分断面間にわたってそれぞれ形成されている。

#### [0170]

このように、第1~第8の主スクライブラインMS13~MS20を、貼り合わせマザー基板90の端面間に形成される分断予定ラインD1~D8の全体にわたって形成し、第1~第4の補助スクライブラインSS13~SS16を貼り合わせマザー基板90の一方の端面から対向する他方の端面にわたってそれぞれ形成し、第5~第8の補助スクライプラインSS17~SS20を貼り合わせマザー基板90の一方の分断面から対向する他方の分断面にわたってそれぞれ形成する方法に限らない。図27に示すように、マザーガラ



## [0171]

この場合には、第1~第8の主スクライプラインMS13~MS20を形成するために、カッターホイール62aを貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92にそれぞれ圧接させ転動させてスクライブを実施すると、垂直クラックが、スクライブ開始位置に対してスクライブ方向の前後方向に伸展するために、形成される第1~第8の主スクライプラインMS13~MS20は、貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92の一方の端面に達する。

# [0172]

同様に、第1~第8の主スクライブラインMS13~MS20のスクライブ終了位置が、貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92の他方の端面の手前であっても、マザー基板91および92の垂直クラックが、スクライブ方向に伸展するために、形成される第1~第8の主スクライブラインMS13~MS20は、マザー基板91および92の他方の端面に達する。

## [0173]

このことから、第1~第8の補助スクライブラインSS13~SS20も、マザー基板90および91の一方の端面または分断された一方の分断面から対向する他方の端面または分断面間にわたってそれぞれ形成する必要がなく、図27に示すように、貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92の一方の端面または分断された一方の分断面から0.2~0.5 mm程度の適当な間隔をあけた位置を、第1~第8の補助スクライブラインSS13~SS20の開始位置とし、同様に、他方の端面または分断面に対して0.2~0.5 mm程度の手前の位置を、第1~第8の補助スクライブラインSS13~SS20の終点位置とするようにしてもよい。

# [0174]

さらには、第1~第8の主スクライブラインMS13~MS20と第1~第8の補助スクライブラインSS13~SS20のいずれか一方を、貼り合わせマザー基板のマザー基板91および92の一方の端面または一方の分断面からマザー基板91および92の他方の端面または他方の分断面にわたって形成して、第1~第8の主スクライブラインMS13~MS20と第1~第8の補助スクライブラインSS13~SS20のいずれか他方を、貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92の一方の端面または一方の分断面とは適当に離れた位置から他方の端面またはマザー基板91および92の他方の分断面の手前にわたって形成するようにしてもよい。

### [0175]

図28は、貼り合わせ基板90からパネル基板90aを分断する別のスクライブパターンを説明する平面図である。このスクライブ方法では、貼り合わせマザー基板90における横方向に沿った第1および第2の分断予定ラインD1およびD2に沿って第1および第2の主スクライブラインMS13およびMS14を、それぞれ、カッターホイール62aによって、貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92の表面からマザー基板91および92のそれぞれの厚さの90%以上に達する垂直クラックによって形成する。その後、第1および第2の主スクライブラインMS13およびMS14の間の領域において、縦方向に沿った第5分断予定ラインD5に沿って第5の主スクライブラインMS17を、カッターホイール62aによって形成するとともに、その第5の主スクライブラインMS17に対して、0.5~1.0mm程度間隔をあけて、パネル基板90a側とは反対側に第5の補助スクライブラインSS17を形成する。

#### [0176]

この場合、第5の主スクライプラインMS17および第5補助スクライプラインSS17、すでに形成されている第1および第2の主スクライプラインMS13およびMS14

とそれぞれ交差し、第5の主スクライブラインMS17および第5の補助スクライプラインSS17は1回のスクライブで連続して形成されるように第5の主スクライブライン17は第2の主スクライブラインMS14を越えた後、180度反転して、第5の補助スクライブラインSS17が形成される。

## [0177]

以後、同様に、第1および第2の主スクライブラインMS13およびMS14の間の領域において、第6の分断予定ラインD8に沿って第6の主スクライブラインMS18を、カッターホイール62aによって形成するとともに、反転連続して、パネル基板90a側とは反対側に第6の補助スクライブラインSS18を形成し、さらには、第7の主スクライブラインMS19および第7の補助スクライブラインSS19、第8の主スクライブラインMS20および第8の補助スクライブラインSS19、第8の主スクライブラインMS20および第8の補助スクライブラインSS17~SS20が、第1および第2の主スクライブラインMS13およびMS14を通過することで、第1および第2の主スクライブラインMS13およびMS14をそれぞれ形成する垂直クラックが、第1および第2の主スクライブラインMS13およびMS14の全体にわたって貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92の貼り合わせ面にまで確実に達する。このため、第1および第2の主スクライブラインMS13およびMS14に沿って貼り合わせマザー基板90が確実に分断されるとともに、一対のパネル基板90aが得られる。

# [0178]

この時点で一対のパネル基板 9 0 a に分断される前、貼り合わせマザー基板 9 0 の未分断の領域を第 2 基板部分 9 0 c とする。

### [0179]

次に、第2の主スクライブラインMS14によって分断された第2基板部分90cを、図28(b)に示すように、貼り合わせマザー基板90における横方向に沿った第3および第4分断予定ラインD3およびD4に沿ってカッターホイール62aを圧接転動させて、貼り合わせマザー基板90のマザー基板91および92の表面からマザー基板91および92のそれぞれの厚さの90%以上に達する垂直クラックによる第3および第4の主スクライブラインMS15およびMS16をそれぞれ形成する。その後、第3および第4の主スクライブラインMS15およびMS16の間の領域において、縦方向に沿った第9分断予定ラインD9に沿った第9の主スクライブラインMS21および第5の補助スクライブラインSS21、第10分断予定ラインD10に沿った第10の主スクライブラインMS22および第10の補助スクライブラインSS22、第11分断予定ラインD11に沿った第11の主スクライブラインSS23、第12分断予定ラインD12に沿った第12の主スクライブラインSS23、第12分断予定ラインD12に沿った第12の主スクライブラインMS24および第12の補助スクライブラインSS24を、それぞれ、第3および第4の主スクライブラインMS15およびMS16と交差するように、パネル基板90aの外側に順番に形成する。これにより、第2基板部分90cが分断されて、一対のパネル基板90aが分断される。

#### [0180]

なお、第5~第12の各補助スクライブラインSS21~SS24は、第1および第3の主スクライブラインMS13およびMS15と交差させる必要がなく、例えば、図29に示すように、第1および第3の主スクライブラインMS13およびMS15に対して、0.2~0.5mm程度手前の位置を第5~第12の各補助スクライブラインSS17~SS24の終点位置としてもよい。この場合も、第5~第12の各補助スクライブラインSS17~SS24を形成する垂直クラックが、スクライブ方向に伸展する。また、第5~第12の各主スクライブラインMS17~MS24は、各主スクライブラインMS17~MS24の全体にわたって分断された状態になる。

#### [0181]

このように、スクライブライン同士を相互に交差させて、基板を分断させる場合には、 図30に示すように、貼り合わせマザー基板90に、第1~第4の各分断予定ラインD1 ~D4に沿って、主スクライブラインMS13~MS16をそれぞれ形成した後に、第1 主スクライブラインMS13と第4主スクライブラインMS16とにそれぞれ交差するように、第5の主スクライブラインMS17および第5の補助スクライブラインSS17、第6の主スクライブラインMS18および第6の補助スクライブラインSS18、第7の主スクライブラインMS19および第7の補助スクライブラインSS19、第8の主スクライブラインMS20および第8の補助スクライブラインSS20を、主スクライブラインと補助スクライブラインが1回のスクライブで連続して形成されるように第4の主スクライブラインMS16を越えた後、180度反転して連続して形成するようにしてもよい

## [0182]

図31は、主スクライブラインMSと補助スクライブラインSSの二重のスクライブラインをもちいて貼り合わせ基板90から表示パネル90aを分断するスクライブパターンを説明する概略平面図である。まず、図20に示すスクライブ方法によって、パネル基板90aに対してスクライブ予定ラインS1~S4に沿った4本のスクライブライン(以下、パネル基板90aの全周にわたる4本の直線状のスクライプラインを主スクライブラインDS1とする)を形成する。その後に、この主スクライブラインDS1に対して、パネル基板90aの外側に、0.5mm~1mm程度の間隔をあけて、主スクライブラインDS1とは平行に4本の直線状のサブスクライブラインDS2を形成する。

### [0183]

このように、主スクライブラインDS1に対して0.5mm~1mm程度の間隔をあけてサブスクライブラインDS2を形成すると、サブスクライブラインDS2の形成時に貼り合わせマザー基板90の表面にスクライブラインの形成方向とは直交する水平方向に応力が加わり、すでに形成されている主スクライブラインDS1を形成する垂直クラックの表面部分に圧縮力が作用する。このように、主スクライブラインDS1を形成する垂直クラックの表面部分に圧縮力が作用すると、垂直クラックの底部には垂直クラックの幅を広げる方向に反力が作用する。これにより、垂直クラックは、貼り合わせマザー基板90の厚さ方向に伸展し、垂直クラックは、貼り合わせマザー基板のマザー基板91および92の貼り合わせ面に到達する。

#### [0184]

なお、この場合には、図32に示すように、主スクライブラインDS1を形成した後に、サブスクライブラインDS2を、カッターホイール62aを貼り合わせマザー基板90の表裏面から離間させることなく、主スクライブラインDS1に連続して形成するようにしてもよい。

## [0185]

さらには、図21に示すように、スクライブ予定ラインS1およびS2に沿ってスクライブラインを形成した後に、スクライブ予定ラインS4およびS2に沿ってスクライブラインを形成する場合にも、図33に示すように、主スクライブラインDS1を形成した後に、サブスクライブラインDS2を形成するようにしてもよい。

### [0186]

また、基板を分断する方法として、上述のように基板が脆性材料基板の一種であるガラス基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板に二重のスクライブライン形成する方法を一例として説明したが、これに限らない。基板が、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板、およびセラミクス基板、ガラス基板、半導体基板等の脆性材料基板である場合には、例えばレーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、切断刃 ダイヤモンドカッター等を用いた基板の分断方法が用いられる。

### [0187]

さらに、基板にはマザー基板の他に、マザー基板同士を組み合わせて貼り合わせた貼り合わせ基板、異なるマザー基板を組み合わせて貼り合わせた貼り合わせ基板、マザー基板を組み合わせて積層させた基板が含まれる。

#### [0188]

## 〈実施の形態2〉

図34は、本発明の基板分断システムの別の実施形態の一例を示す全体概略斜視図、図35はその基板分断システムの平面図、図36はその基板分断システムの側面図である。なお、本発明において、「基板」には、複数の基板に分断されるマザー基板を含み、また、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板およびセラミックス基板、半導体基板、ガラス基板等の脆性材料基板等の単板が含まれる。さらに、このような単板に限らず、一対の基板同士を貼り合わせた貼り合わせ基板、一対の基板同士を積層させた積層基板も含まれる。

## [0189]

本発明の基板分断システムは、例えば、一対のガラス基板が、相互に貼り合わせられた 液晶表示装置のパネル基板(表示パネル用貼り合わせ基板)を製造する際、この基板分断 システムによって、一対のマザーガラス基板が相互に貼り合わされた貼り合わせマザー基 板90が、複数枚のパネル基板(表示パネル用貼り合わせ基板)に分断される。

# [0190]

本実施の形態2の基板分断システム200は位置決めユニット部220、スクライブユニット部240、リフトコンベア部260、スチームブレイクユニット部280、基板搬送ユニット部300、パネル反転ユニット部320、パネル端子分離部340を備えている。

### [0191]

本実施の形態2の基板分断システム200において、位置決めユニット部220が配置されている側を基板搬入側、パネル端子分離部340が配置されている側を基板搬出側として以下の説明を行う。また、本発明の基板分断システム200において、基板が搬送されていく方向(基板の流れ方向)は基板搬入側から基板搬出側に向かう+Y方向である。また、この基板が搬送されていく方向はスクライブユニット部240のスクライブ装置ガイド体242はX方向に沿って設けられる。

### [0192]

基板として貼り合わせマザー基板90を分断する場合を例に挙げて以下の説明を行う。まず、前工程の搬送装置(不図示)によって貼り合わせマザー基板90が位置決めユニット部220へ搬入される。その後、位置決めユニット部220は貼り合わせマザー基板90をスクライブユニット部240の第1基板支持部241Aに載置して、第1基板支持部241A上で貼り合わせマザー基板90を位置決めする。

# [0193]

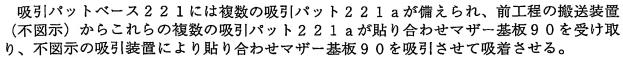
位置決めユニット部220は図37に示すように、架台230の上方に支柱228を介してY方向に沿って架台230の一方の側縁に沿って延在するガイドバー226とガイドバー226と平行に架台230の他方の側縁に沿って延在するガイドバー227を備える。また、ガイドバー226とガイドバー227の間の架台230の基板搬入側には、架台230の上方に支柱228を介してX方向に沿って延在するガイドバー225を備えている。

### [0194]

ガイドバー225とガイドバー226には貼り合わせマザー基板90を位置決めする際に基準となる複数の基準ローラ223がそれぞれ設けられており、ガイドバー227には、貼り合わせマザー基板90を位置決めする際にガイドバー226に備えられた基準ローラ223に向けて貼り合わせマザー基板90を押し込む複数のプッシャー224が備えられる。

架台230の上方にはガイドバー226とガイドバー227の間に所定の間隔で複数の吸引パットベース221が設けられ、それらの吸引パットベース221は、架台230のガイドバー226側の上面に設けられた昇降装置222と架台230のガイドバー227側の上面に設けられた昇降装置222に保持される。

## [0195]



## [0196]

スクライブユニット部 2 4 0 の第 1 基板支持部 2 4 1 A は基板搬入側へ移動して、位置 決めユニット部 2 2 0 の位置で待機状態となって、その待機状態の第 1 基板支持部 2 4 1 A の中に昇降装置 2 2 2 によって、貼り合わせマザー基板 9 0 を保持した複数の吸引パットベース 2 2 1 が沈みこみ第 1 基板支持部 2 4 1 A 上に貼り合わせマザー基板 9 0 が載置 される。

スクライブユニット部 2 4 0 は実施の形態 1 の基板分断システム 1 から基板搬出装置 8 0 とスチームユニット部 1 6 0 を取り除いた構成であり、その他の機械構成については実施例 1 と同様の構成となっている。

スクライブユニット部240のスクライブ装置ガイド体242は第1基板支持部241A および第2基板支持部241Bと結合されておりスクライブ装置ガイド体242のY方向 の移動に伴って、同時に、第1基板支持部241Aと第2基板支持部241Bがスクライ ブ装置ガイド体242と同方向に移動する。

### [0197]

第1基板支持部241Aおよび第2基板支持部241Bには、それぞれがスクライブ装置ガイド体242の移動方向と同方向に移動可能になった複数の第1基板支持ユニット244Aおよび複数の第2基板支持ユニット244Bをそれぞれ備えている。各第1基板支持ユニット244Bは、それぞれ、フレーム243Aおよび243Bに対して平行な方向(Y方向)に沿った直線状に構成されている。

### [0198]

第1基板支持部241Aに設けられた1つの第1基板支持ユニット244Aは実施の形態1の図6に示す第1基板支持ユニット21Aと同様であり、第1基板支持ユニット244Aに備えられたタイミングベルトは第1基板支持部241Aに備えられるクラッチが駆動軸と連結したときに周回移動させられる。

#### [0199]

第1基板支持ユニット244Aは所定の間隔を設けて複数配置され、スクライブ装置ガイド体242とともにフレーム243Aおよび243Bに沿ってY方向へ移動する。

## [0200]

このように構成される第1基板支持ユニット244Aのタイミングベルトを周回移動させる機構は、実施の形態1の図7乃至図9と同様であり、図7においてフレーム11Aおよび11Bがそれぞれ本実施の形態2におけるフレーム243Aおよび243Bとなっている。

#### [0201]

図7に示すように、第1基板支持部241Aに設けられた複数の第1基板支持ユニット 244Aの駆動用タイミングプーリを回転させてタイミングベルトを周回移動させるクラッチを備えるクランプユニットは、フレーム243Aおよび243B側に備えられる。

#### [0202]

図36に示すように、第1基板支持ユニット244Aを支持するフレーム243A側の支柱245とフレーム243B側の支柱245がガイドベース247に保持され、スクライブ装置ガイド体242の両端を支持する支柱246を保持するガイドベース247にリニアモータの可動子(図示せず)が取り付けられているため、リニアモータの駆動により、スクライブ装置ガイド体242が基板搬入側へ移動するとともに、第1基板支持部241Aの複数の第1基板支持ユニット244Aが基板搬入側へ移動する。

### [0203]

スクライブ装置ガイド体242が移動する時、フレーム243Aおよび243Bに沿って、図8と同様に取り付けられたそれぞれのラックとかみ合っているフレーム243A側のクラッチユニットのピニオンとフレーム243B側のピニオンが回転させられる。

# [0204]

第1基板支持ユニット244Aの駆動用タイミングプーリを回転させてタイミングベルトを周回移動させるには、フレーム243Aおよびフレーム243Bの両方のクラッチをピニオンの回転が伝達される駆動軸と連結させてもよいし、フレーム243Aまたはフレーム243Bのいずれかのクラッチをピニオンの回転が伝達される駆動軸と連結させてもよい。

# [0205]

第2基板支持部241Bは、スクライブ装置ガイド体242の移動方向と同方向に移動可能になった複数の第2基板支持ユニット244Bを備えている。この第2基板支持ユニット244Bは第1基板支持ユニット244Aの構造と同様であり、スクライブ装置ガイド体242に対して対称となるように、Y方向の取付け方向が逆になるように、フレーム243A側の支柱245とフレーム243B側の支柱245に支持され、それぞれの支柱がガイドベース247に保持されている。

### [0206]

スクライブ装置ガイド体242の両端を支持する支柱246を保持するガイドベース247にリニアモータの可動子(図示せず)が取り付けられているため、リニアモータの駆動により、スクライブ装置ガイド体242が基板搬入側へ移動するとともに、第2基板支持部241Bの複数の第2基板支持ユニット244Bが基板搬入側へ移動する。

## [0207]

第2基板支持部241Bのフレーム243A側とフレーム243B側には第1基板支持部241Aと同様のクラッチユニット備えられており、スクライブ装置ガイド体242が移動する時、フレーム243Aおよび243Bに沿って取り付けられたそれぞれのラックとかみ合っているフレーム243A側のクラッチユニットのピニオンが回転させられる。

## [0208]

第2基板支持ユニット244Bの駆動用タイミングプーリを回転させてタイミングベルトを周回移動させるには、フレーム243A側およびフレーム243B側の両方のクラッチをピニオンの回転が伝達される駆動軸と連結させてもよいし、フレーム243Bのいずれか一方のクラッチをピニオンの回転が伝達される駆動軸と連結させてもよい。

### [0209]

さらに、架台250の上方には、第1基板支持部241Aに支持された貼り合わせマザー基板90をクランプするクランプ装置251が設けられている。たとえば、クランプ装置251は、図34に示すように、貼り合わせマザー基板90におけるフレーム243Bに沿った側縁部をクランプするように、フレーム243Bに一定の間隔をあけて取り付けられた複数のクランプ装置251と、貼り合わせマザー基板90における基板搬入側の側縁部をクランプするために、フレーム243Bとは直交する方向に沿って一定の間隔をあけて配置された複数のクランプ装置251とを備えている。

#### [0210]

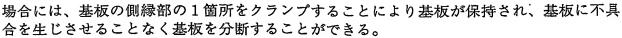
それぞれのクランプ装置 2 5 1 の動作は実施の形態 1 の図 1 2 および図 1 3 で説明した動作と同様であるため、ここではその動作の説明を省略する。

# [0211]

また、クランプ装置251の配置は、貼り合わせマザー基板90を保持するクランプ装置251をフレーム243Bとフレーム243Bと直交する方向の基板搬入側に備える場合に限らず、フレーム243Bにのみクランプ装置251を備える場合であっても、貼り合わせマザー基板90は損傷を受けることなく保持される。

## [0212]

上記のクランプ装置 2 5 1 は本発明の基板分断システムに用いられる一例を示したものであり、これに限定されるものではない。すなわち、貼り合わせマザー基板 9 0 における側縁部を把持または保持する構成のものであればよい。また、例えば基板サイズが小さい



# [0213]

スクライブ装置ガイド体242における上側ガイドレール252には、実施の形態1の図3に示す上部基板分断装置60が取り付けられており、また、下側ガイドレール354には、実施の形態1の図4に示す上部基板分断装置60と同様の構成であって、上下を反転した状態の下部基板分断装置70が取り付けられている。上部基板分断装置60および下部基板分断装置70は、それぞれ、リニアモータによって、上側ガイドレール252および下側ガイドレール253に沿ってスライドするようになっている。

### [0214]

例えば、上部基板分断装置 6 0 及び下部基板分断装置 7 0 には、実施の形態 1 の図 3 および図 4 で示されるものと同様の貼り合わせマザー基板 9 0 をスクライブするカッターホイール 6 2 a がチップホルダ 6 2 b に回転自在に取り付けられており、さらに、チップホルダ 6 2 b はクランプ装置 2 5 1 によって保持された貼り合わせマザー基板 9 0 の表裏面に対して垂直方向を軸として回転自在にカッターヘッド 6 2 c に取り付けられている。そして、カッターヘッド 6 2 c は図示しない駆動手段により貼り合わせマザー基板 9 0 の表裏面に対して垂直方向に沿って移動自在になっており、カッターホイール 6 2 a には、図示しない付勢手段により適宜、荷重がかけられるようになっている。

### [0215]

チップホルダ62bに保持されたカッターホイール62aとしては、例えば、特開平9-188534号公報に開示されているように、幅方向の中央部が鈍角のV字状になるように突出した刃先を有しており、その刃先に、所定の高さの突起が刃先稜線に所定のピッチで形成されているものが用いられる。

## [0216]

下側ガイドレール253に設けられた下部基板分断装置70は、上部基板分断装置60と同様の構成になっており、上部基板分断装置60とは上下を反転した状態で、そのカッターホイール62a(図4参照)が、上部基板分断装置60のカッターホイール62aと対向するように配置されている。

### [0217]

上部基板分断装置60のカッターホイール62aは、上述した付勢手段とカッターヘッド62cの移動手段とにより、貼り合わせマザー基板90の表面に圧接され、下部基板分断装置70のカッターホイール62aも、上述の付勢手段とカッターヘッド62cの移動手段とにより、貼り合わせマザー基板90の裏面に圧接される。そして、上部基板分断装置60と下部基板分断装置70とを同時に同一の方向へ移動させることにより、貼り合わせマザー基板90は分断されていく。

## [0218]

このカッターホイール62aはWO 03/011777に開示されているサーボモータを用いたカッターヘッド65に回転自在に支持されることが望ましい。サーボモータを用いたカッターヘッド65の一例として、図14は、カッターヘッド65の側面図を示し、図15にその主要部の正面図を示す。一対の側壁65a間にサーボモータ65bが倒立状態で保持され、その側壁65aの下部には、側方から見てL字状のホルダー保持具65cが支軸65dを通じて回動自在に設けられている。そのホルダー保持具65cの前方(図15中、右方向)には、軸65eを介してカッターホイール62aを回転自在に支持するチップホルダ62bが取り付けられている。サーボモータ65bの回転軸と支軸65dとには、平傘歯車65fが互いにかみ合うように装着されている。これにより、サーボモータ65bに正逆回転により、ホルダー保持具65cは支軸65dを支点

#### [0219]

図16はサーボモータを用いたカッターヘッドの別の一例を示す正面図であり、サーボ

として俯仰動作を行ない、カッターホイール62aが上下動する。このカッターヘッド6

5 自体は、上部基板分断装置 6 0 と下部基板分断装置 7 0 に備えられる。

モータ65bの回転軸をホルダー保持具65cに直結したものである。

図14及び図16のカッターヘッドはサーボモータを位置制御により回転させることで、カッターホイール62aを昇降させて位置決めする。これらのカッターヘッドはカッターヘッドを水平方向へ移動させて貼り合わせマザー基板90にスクライブラインを形成するスクライブ動作中に、予めサーボモータ65b設定されたカッターホイール62aの位置がズレたときに、その設定位置へ戻すように働く回転トルクを制限して脆性材料基板に対するスクライブ圧をカッターホイール62a伝達するようになっている。すなわち、サーボモータ65bはカッターホイール62aの鉛直方向の位置を制御するとともに、カッターホイール62aに対する付勢手段となる。

# [0220]

上述したサーボモータを用いたカッターヘッドを用いることで、貼り合わせマザー基板 90をスクライブする時に、カッターホイールが受ける抵抗力の変動によるスクライブ圧 の変化に瞬時に対応してサーボモータの回転トルクが修正されるため、安定したスクライブが実施でき、品質のよいスクライブラインを形成することができる。

### [0221]

尚、貼り合わせマザー基板90をスクライブするダイヤモンドポイントカッターやカッターホイールなどのスクライブカッターを振動させて、スクライブカッターによる貼り合わせマザー基板90への押圧力を周期的に変化させる機構を備えるカッターヘッドも本発明の基板分断システムのマザー基板の分断に有効に適用される。

### [0222]

尚上部基板分断装置60及び下部基板分断装置70は上記の構成に限るものではない。 すなわち、基板の表裏面を加工して基板を分断させる構成の装置であればよい。

#### [0223]

例えば、上部基板分断装置60及び下部基板分断装置70がレーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、切断刃 ダイヤモンドカッター等を用いてマザー基板を分断させる 装置であってもよい。

## [0224]

マザー基板が、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板、およびセラミックス基板、ガラス基板、半導体基板等の脆性材料基板である場合には、例えばレーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、切断刃 ダイヤモンドカッター等を用いてマザー基板を分断する基板分断装置が用いられる。

#### [0225]

さらに、一対のマザー基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板、異なるマザー基板を 組み合わせて貼り合わせた貼り合わせマザー基板、複数のマザー基板同士を組み合わせて 積層させた基板を分断する場合にも上述のマザー基板を分断するものと同様の基板分断装 置が用いられる。

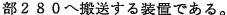
## [0226]

また、上部基板分断装置60及び下部基板分断装置70には基板の分断を補助する分断補助手段を備えていてもよい。分断補助手段としては、例えば、ローラなどを基板に押圧させたり、圧縮空気を基板に向けて噴射させたり、レーザを基板に照射するか、熱風などを基板に吹きかけて基板を温める(熱する)ものが一例として挙げられる。

#### [0227]

さらに、上述の説明においては、上部基板分断装置 6 0 及び下部基板分断装置 7 0 が同一の構成である場合を説明したが、基板の分断パターンや基板の分断条件により異なる構成の装置であってもよい。

リフトコンベア部260はスクライブユニット部240のスクライブ装置ガイド体242の上部基板分断装置60及び下部基板分断装置70によって貼り合わせマザー基板90がスクライブされた後、クランプ装置251による貼り合わせマザー基板90のクランプ(保持)が解除されて、第2基板保持部241Bの複数の第2基板支持ユニット244Bに載置されたスクライブ加工済みの貼り合わせガラス基板90をスチームブレイクユニット



# [0228]

図38はリフトコンベア部260の平面図であり、図39はリフトコンベア部260を構成する第3の基板支持ユニット261の側面図である。

### [0229]

第3基板支持ユニット261は、フレーム243Aおよびフレーム243Bと平行な方向(Y方向)に沿って直線状に延びる支持本体部261aを有しており、支持本体部261aの各端部に、例えば、タイミングベルト261eを案内するタイミングプーリ261cおよび261dがそれぞれ取り付けられている。駆動用タイミングプーリ261bは回転モータ267の回転がベルト268により伝達される回転軸と連結しており、タイミングベルト261eを周回移動させるものである。

# [0230]

複数の第3基板支持ユニット261が所定の間隔をおいてリフトコンベア部260に配置され、その間隔にスクライブユニット部240の第2基板支持部241Bの複数の第2基板支持ユニット244Bが挿入されるように複数の第3基板支持ユニット261は保持フレーム262に支柱265を介して保持される。

#### [0231]

フレーム 243 A 側 およびフレーム 243 B 側 の 保持フレーム 262 の それぞれのフレーム 262 の 中央部には、シリンダー 266 が 備えられ、それらのシリンダー 266 の 本体は 架台 270 の 上面にそれぞれ接合され、それらのシリンダー 266 の ロッドは 保持フレーム 262 の それぞれのフレーム 262 の それぞれのフレーム 262 の でれぞれのフレーム 262 の でれぞれのフレーム 262 の でれぞれのフレーム 262 の の 上面に 備えられる リニアガイド 263 に それぞれ 挿入される。

### [0232]

スクライブユニット部240のスクライブ装置ガイド体242の上部基板分断装置60及び下部基板分断装置70によって貼り合わせマザー基板90がスクライブされた後、クランプ装置251による貼り合わせマザー基板90のクランプ(保持)が解除されて、第2基板保持部241Bの複数の第2基板支持ユニット244Bに載置されたスクライブ加工済みの貼り合わせガラス基板90は、シリンダー266の駆動により、複数の第3基板支持ユニット261に載せられて鉛直方向に沿って上方(+2方向)の所定の位置へ移動させられた後、回転モータ267が回転してタイミングベルト261eが移動することにより、スチームブレイクユニット部280へ搬送させられる。

#### [0233]

スチームプレイクユニット部280はY方向に沿って移動せず、固定であること以外は、実施の形態1の図10に示すスチームユニット部160と同様の構成である。

スチームプレイクユニット部280は貼り合わせマザー基板90の上側のマザー基板91 に蒸気を吹き付ける複数個のスチームユニット284を取り付ける上側スチームユニット取付けバー281と貼り合わせマザー基板90の下側のマザー基板92に蒸気を吹き付ける複数個のスチームユニット284を取り付ける下側スチームユニット取付けバー282がスクライブ装置ガイド体242と平行にX方向に沿って支柱283に取り付けられている。

スクライブユニット部 2 4 0 のフレーム 2 4 3 Aおよび 2 4 3 B側のそれぞれの支柱 2 8 3 は、それぞれ架台 2 7 0 の上面に接合されている。また、スチームブレイクユニット部 2 8 0 の基板搬出側には、スチームユニット 2 8 4 から貼り合わせマザー基板 9 0 の表裏面に蒸気を噴射させた後、完全分断された貼り合わせマザー基板 9 0 を支持して搬送する例えばシート状のベルトが周回移動するベルトコンベア 2 8 5 が備えられる。

### [0234]

尚、スチームプレイクユニット部280の基板搬出側に備えられたベルトコンベア285の周回移動速度はリフトコンベア部260の複数の第3基板支持ユニット261のタイミングベルト261e周回移動速度とほぼ同一に設定され同期して移動する。



スチームブレイクユニット部280は実施の形態1の図10に示すスチームユニット部160と同様の構成をしており、複数個のスチームユニット284が上側スチームユニット取付けバー281に取り付けられ、複数個のスチームユニット284が上側の複数のスチームユニット284対して間隙GAを開けて下側スチームユニット取付けバー282に取り付けられる。尚間隙GAは貼り合わせマザー基板90がその間隙GAを通過するように調整される。

## [0236]

スチームユニット284の構造は実施の形態1の図11に示すスチームユニット部160と同様の構造であり、スチームユニット284はそのほぼ全体がアルミ材質で構成されており、鉛直方向に複数本のヒーター161aが埋め込まれている。自動操作で開閉する開閉弁(不図示)が開くと水が水供給口161bからスチームユニット284内に流入し、ヒーター161aで熱せられて、供給された水が気化して蒸気となる。その蒸気が導通孔161cを通って噴出口161dからマザー基板の表面へ向けて吹き付けられる。

### [0237]

また、上側スチームユニット取付けバー281の基板搬出側には、マザー基板90の上面に蒸気が吹き付けられた後、マザー基板90の表面に残った水分を除去するためのエアーナイフ286が備えられている。

尚、下側スチームユニット取付けバー282にも上側スチームユニット取付けバー282 取り付けられるものと同様のスチームユニット284とエアーナイフ286が備えられる

### [0238]

第2基板支持ユニットに載せられたスクライブ済みの貼り合わせマザー基板90は第3基板支持ユニット261に載せられて鉛直方向に沿って上方(+2方向)の所定の位置へ移動させられた後、複数の第3基板支持ユニット261のタイミングベルト361e周回移動速度とほぼ同じ周回移動速度でスチームブレイクユニット部280の基板搬出側に備えられたベルトコンベア285を移動させることにより、スクライブ済みの貼り合わせマザー基板90はスチームブレイクユニット部280を通過することでパネル基板90aに分断され、ベルトコンベア285に支持される状態となる。

#### [0239]

基板搬送ユニット部300は、スチームプレイクユニット部280を通過することで貼り合わせマザー基板90が分断され、ベルトコンベア285に支持される状態となった移動中および停止中のパネル基板90aを取り上げてパネル反転ユニット部320の反転搬送ロボット321のパネル保持部322に載置する装置である。

架台270および基板搬送ユニット部の架台330の上方には、貼り合わせマザー基板90から分断されたパネル基板を搬出する搬出ロボット310を基板の流れ方向であるY方向と直交するスチームブレイクユニット部280とスクライブ装置ガイド体242と平行なX方向に移動可能とするための基板搬出装置用ガイド301が架設されている。基板搬出ユニット部300は、架台270および330の上面に支柱302を介してフレーム243A側およびフレーム243B側にそれぞれ設けられたガイド303に沿って、基板搬出装置用ガイド301の両端部が支持部材304を介して、リニアモータによってスライドするようになっている。この場合のリニアモータは、それぞれのガイド303にそれぞれ設けられたリニアモータの固定子内に、支持部材304にそれぞれ取り付けられたリニアモータの可動子(図示せず)がそれぞれ挿入されて構成されている。

### [0240]

搬出ロボット310には、貼り合わせマザー基板90から分断された各パネル基板90aを吸引吸着させる吸着部(図示せず)が設けられており、吸着部によって表示パネル90aが吸着された状態で、搬出ロボット310が、基板搬出側にスライドされることにより、パネル反転ユニット部320の反転搬送ロボット321のパネル保持部322に載置する。

基板搬送ユニット部300の搬出ロボット310の構成は実施の形態1の図5に示す搬出ロボット140と同様であるので、ここでの詳細な説明は省略する。尚、搬出ロボット310は基板搬出装置用ガイド301に取り付けられ、リニアモータまたはサーボモータの駆動手段と直線ガイドとを組み合わせた移動機構により基板搬出装置用ガイド301に沿う方向(X方向)に移動自在となっている。

また、搬出ロボット310による貼り合わせマザー基板90から分断されたパネル基板90aの搬送において、分断されたパネル基板90aは不図示の吸引機構による吸引により搬出ロボット310の吸着パットで保持し、搬出ロボット310全体が昇降機構(不図示)により、一旦上昇した後、次工程のパネル反転ユニット部320の反転搬送ロボット321へ搬送され、再び、昇降機構(不図示)により搬送ロボット310が下降し、次工程のパネル反転ユニット部320の反転搬送ロボット321のパネル保持部322の所定の位置へ予め決まられた状態で載置される。

## [0241]

パネル反転ユニット部320には反転搬送ロボット321が備えられ、基板搬送ユニット部300の搬出ロボット310からパネル基板90aを受け取りパネル基板90aの表裏を反転してパネル端子分離部340の分離テーブル341上に載置する。

#### [0242]

反転搬送ロボット321のパネル保持部322は例えば複数の吸着パットを備えており、反転搬送ロボット321のロボット本体部323に対して回転自在に保持される。

#### [0243]

反転搬送ロボット321によりパネル端子分離部340の分離テーブル341上に載置されたパネル基板90aは例えば挿入ロボット(不図示)により図40に示すような分離テーブル341の各側縁部付近に設けられた不要部分除去機構342によりパネル基板90aの不要部99をパネル基板90aから分離する。

不要部分除去機構 3 4 2 は、図 4 0 に示すように、相対した一対のローラ 3 4 2 b をそれぞれ有する複数の除去ローラ部 3 4 2 a が、分離テーブル 3 4 1 の各側縁に沿って所定のピッチで配置されて構成されている。各除去ローラ部 3 4 2 a に設けられた相対する各ローラ 3 4 2 b は、相互に接近する方向に付勢されており、両ローラ 3 4 2 b の間に、挿入ロボット(不図示)によりパネル基板 9 0 a の上側の基板の不要部分 9 9 とパネル基板 9 0 a の下側の側縁部が挿入される。各ローラ 3 4 2 b は、パネル基板 9 0 a の各ローラ 3 4 2 b 間への挿入方向の 1 方向にのみ回転し、相対する一対のローラ 3 4 2 b はそれぞれ、回転方向が逆向きの回転するように設定されている。

#### [0244]

このような構成の実施の形態2の基板分断システムの動作について、大判のガラス板を貼り合わせた貼り合わせ基板を分断する場合の一例を主に説明する。

### [0245]

大判のガラス基板が相互に貼り合わせられた貼り合わせマザー基板90を、複数の表示パネル90a(図18参照)に分断する際には、前工程の搬送装置(不図示)から実施の形態2の位置決めユニット部220の複数の吸引パットベース221に備えられた複数の吸引パット221aが貼り合わせマザー基板90を受け取り吸着する。

#### [0246]

また、スクライブユニット部240の第1基板支持部241Aおよび第2基板支持部241Bの4つのクラッチは、各第1基板支持ユニット244Aおよび各第2基板支持ユニット244Bのタイミングベルトを周回移動させるタイミングプーリが回転しないように駆動軸との結合を解除させる(以下の説明においてはこの状態にすることをクラッチをOFFさせると呼ぶ)。

#### [0247]

クラッチがOFFされた状態で図41のように第1基板支持部241Aは基板搬入側へスクライブ装置ガイド体242および第2基板支持部241Bと伴に移動し、位置決めユニット部220で待機する。

その後、図42に示すように待機状態の第1基板支持部241Aの中に昇降装置222によって、貼り合わせマザー基板90を保持した複数の吸引パットベース221が沈みこみ、複数の吸引パットによる貼り合わせマザー基板の吸着状態を解除して、第1基板支持部241A上に貼り合わせマザー基板90が載置される。

### [0248]

このように、貼り合わせマザー基板90が、第1基板支持部241A上に載置された状態、第1基板支持部241Aおよび第2基板支持部241Bの4つのクラッチをOFFさせた状態で、第1基板支持部241Aが基板搬入側へスクライブ装置ガイド体242および第2基板支持部241Bと伴に僅かに移動し、貼り合わせマザー基板90の基板搬入側の側縁を位置決めユニット部220のガイドバー225に備えられている複数の基準ローラ223と当接させる。

貼り合わせマザー基板90の基板搬入側の側縁を位置決めユニット部220のガイドバー225に備えられている複数の基準ローラ223と当接させた後、位置決めユニット部220のガイドバー227のプッシャー224がガイドバー226の基準ローラ223に向けて貼り合わせマザー基板90を押し込み、貼り合わせマザー基板90のガイドバー226側の側縁とガイドバー226に備えられた基準ローラ223と当接させることにより、スクライブユニット部240の第1基板支持部241A内に貼り合わせマザー基板90を位置決めする。

# [0249]

その後、位置決めユニット部220のガイドバー227のプッシャー224によるガイドバー226の基準ローラ223に向けての貼り合わせマザー基板90の押し込み状態が解除され、第1基板支持部241Aおよび第2基板支持部241Bの4つのクラッチをOFFさせた状態で、第1基板支持部241Aはスクライブ装置ガイド体242および第2基板支持部241Bと共に移動し、貼り合わせマザー基板90がクランプ装置251で保持される位置へ移動した後、貼り合わせマザー基板90の側縁部がクランプ装置251によりクランプされる。

### [0250]

貼り合わせマザー基板90の相互に直交する各側縁部がそれぞれクランプ装置251によってクランプされると、貼り合わせマザー基板90の側縁部をクランプしている各クランプ具が貼り合わせマザー基板の自重によりほぼ同時に沈み込むため、貼り合わせマザー基板90が全ての第1基板支持ユニット244Aのタイミングベルトによって補助的に支持された状態とされる。

#### [0251]

図43に示すように、貼り合わせマザー基板90の相互に直交する各側縁部がそれぞれクランプ装置251によってクランプされ第1基板支持ユニット244Aに支持された状態となると、スクライブユニット部240の第1基板支持部241Aおよび第2基板支持部241Bの4つのクラッチは、各第1基板支持ユニット244Aおよび各第2基板支持ユニット244Bの各タイミングベルトを周回移動させるタイミングプーリが回転するように駆動軸と結合される(以下の説明においてはこの状態にすることをクラッチをONさせると呼ぶ)。

第1基板支持部241Aと第2基板支持部241Bの4つのクラッチユニットのクラッチがONされた後、スクライブ装置ガイド体242が、クランプ装置251によって水平状態にクランプされた貼り合わせマザー基板90における基板搬出側の側縁部上の所定位置になるように、基板搬入側にスライドされる。そして、スクライブ装置ガイド体242に設けられた第1光学装置および第2光学装置がそれぞれの待機位置からスクライブ装置ガイド体242に沿って移動することにより、それぞれ貼り合わせマザー基板90に設けられた第1アライメントマークと第2アライメントマークを撮像する。

## [0252]

スクライブ装置ガイド体242がスライドすることにより、第1基板支持部241Aが、基板搬入側にスライドされ、第2基板支持部241Bが基板搬入側へスライドされると

とともに、第1基板支持部241Aの第1基板支持ユニット244Aのタイミングベルトと第2基板支持部241Bの第2基板支持ユニット244Bのタイミングベルトが、貼り合わせマザー基板90をスクライブ装置ガイド体242の移動速度と同一の速度でスクライブ装置ガイド体242の移動方向とは逆方向に貼り合わせガラス基板90移動させようとするため、貼り合わせマザー基板90は移動せず、クランプ装置251に保持されたまま、貼り合わせマザー基板90は第1基板支持部241Aの第1基板支持ユニット244Aのタイミングベルトと第2基板支持部241Bの第2基板支持ユニット244Bのタイミングベルトに摺接することなく支持される状態になる。

# [0253]

次に、第1アライメントマークと第2アライメントマークの撮像結果に基づいて、図示しない演算処理装置によりクランプ装置251によって水平状態で支持された貼り合わせマザー基板90のスクライブ装置ガイド体242に沿った方向に対する傾き、分断開始位置と分断終了位置を演算によって求め、その演算結果に基づいて、上部基板分断装置60 および下部基板分断装置70とともに、スクライブ装置ガイド体242も移動させて貼り合わせマザー基板90を分断する。(これを直線補間によるスクライブあるいは分断と呼ぶ)

この場合、貼り合わせマザー基板90の表面および裏面にそれぞれ対向したカッターホイール62aを、各表面および裏面にそれぞれ圧接して転動させることにより、貼り合わせマザー基板90の表面および裏面にスクライブライン95が形成される。

図44は上部基板分断装置60のカッターホイール62aおよび下部基板分断装置70のカッターホイール62aをそれぞれ圧接させて転動させて貼り合わせマザー基板90から4枚のパネル基板を分断させるために、4枚のパネル基板90aの側縁部にスクライブライン95の形成を完了した時、第2基板支持部241Bが貼り合わせマザー基板を支持している状態を示す図である。

# [0254]

貼り合わせマザー基板90は、例えば、図44に示すように上側ガイドレール252および下側ガイドレール253に沿った列方向に2つの表示パネル90aを、2列にわたって分断するようになっており、貼り合わせマザー基板90から4個の表示パネル90aを分断するために、表示パネル90aの側縁に沿って、上部基板分断装置60のカッターホイール62aおよび下部基板分断装置70のカッターホイール62aをそれぞれ圧接させて転動させる。

#### [0255]

この場合、上部基板分断装置60のカッターホイール62aと、下部基板分断装置70のカッターホイール62aにより、各ガラス基板における各カッターホイール62aの転接部分にそれぞれ垂直クラックが生成されてスクライブライン95が形成される。しかも、各カッターホイール62aの刃先には、周方向に所定のピッチで突起部がそれぞれ形成されているために、各ガラス基板には、厚さ方向にガラス基板の厚さの約90%の長さの垂直クラックが形成される。

#### [0256]

また、貼り合わせマザー基板90をスクライブするダイヤモンドポイントカッターやカッターホイールなどのスクライブカッターを振動させて、スクライブカッターによる貼り合わせマザー基板90への押圧力を周期的に変化させる機構を備えるカッターヘッドを用いてスクライブ方法も本発明の基板分断システムの貼り合わせマザー基板の分断に有効に適用される。

貼り合わせマザー基板90の表裏面のスクライブ加工が完了し、図44に示す状態になると、クランプ装置251による貼り合わせマザー基板90のクランプ(保持)が解除され、貼り合わせマザー基板90が第2基板支持部241に載置されるとともに第2基板保持部241Bの4つのクラッチユニットのクラッチがOFFされる。

### [0257]

その後、図45に示すようにスクライブ済みの貼り合わせマザー基板90を載せた第2

基板支持部241Bは第1基板支持部241Aとスクライブ装置ガイド体242とともに 基板搬出側へ移動し、リフトコンベア部260に所定の間隔で配置されている複数の第3 基板支持ユニット261の間隔に挿入される位置に移動する。

尚、上部基板分断装置60のカッターホイール62aおよび下部基板分断装置70のカッターホイール62aをそれぞれ圧接させて転動させて貼り合わせマザー基板90から4枚のパネル基板を分断させるために、4枚のパネル基板90aの側縁部にスクライブラインを形成するスクライブ方法としては、図44で示すものとは別に実施の形態1の図19乃至図21に示すスクライブ方法も本実施の形態2の基板分断システムに有効に適用することができる。

### [0258]

複数の第3基板支持ユニット261が所定の間隔をおいてリフトコンベア部260に配置され、その間隔にスクライブユニット部240の第2基板支持部241Bの複数の第2基板支持ユニット244Bが挿入されるように複数の第3基板支持ユニット261は図39に示すように保持フレーム262に支柱265を介して保持され、図46に示すように、複数の第3基板支持ユニット261がスクライブ済みの貼り合わせマザー基板90を受け取るタイミングベルト261eの面が第2基板支持ユニット244Bのスクライブ済みの貼り合わせマザー基板90が載置される面よりも下方に位置するように配置される。

### [0259]

スクライブユニット部240のスクライブ装置ガイド体242の上部基板分断装置60及び下部基板分断装置70によって貼り合わせマザー基板90がスクライブされた後、クランプ装置251による貼り合わせマザー基板90のクランプ(保持)が解除されて、第2基板保持部241Bの複数の第2基板支持ユニット244Bに載置されたスクライブ加工済みの貼り合わせガラス基板90は、シリンダー266の駆動により、複数の第3基板支持ユニット261に載せられて鉛直方向に沿って上方(+Z方向)の所定の位置へ移動させられた後、回転モータ267が回転してタイミングベルト261eが移動することにより、スチームブレイクユニット部280へ搬送させられる。

スチームプレイクユニット部280には貼り合わせマザー基板90の上側のマザー基板91に蒸気を吹き付ける複数個のスチームユニット284を取り付ける上側スチームユニット取付けバー281と貼り合わせマザー基板90の下側のマザー基板92に蒸気を吹き付ける複数個のスチームユニット284を取り付ける下側スチームユニット取付けバー282がスクライブ装置ガイド体242と平行なX方向に沿って支柱283に取り付けられている。

スチームプレイクユニット部280の基板搬出側に備えられたベルトコンベア285の周回移動速度はリフトコンベア部260の複数の第3基板支持ユニット261のタイミングベルト261e周回移動速度とほぼ同一に設定され同期して移動させられ、スクライブ済みの貼り合わせマザー基板90はスチームブレイクユニット部280を通過する。

# [0260]

また、上側スチームユニット取付けバー281の基板搬出側には、エアーナイフ286が備えられており、下側スチームユニット取付けバー282にも上側スチームユニット取付けバー282取り付けられるものと同様のスチームユニット284とエアーナイフ286が備えられ、貼り合わせマザー基板90の表裏面に蒸気が吹き付けられた後、貼り合わせマザー基板90の表裏面に残った水分が完全に除去される。

# [0261]

貼り合わせマザー基板90は複数の第3基板支持ユニット261に載せられて鉛直方向に沿って上方(+ 2方向)の所定の位置へ移動させられた後、複数の第3基板支持ユニット261のタイミングベルト261eの周回移動速度とほぼ同じ周回移動速度でスチームプレイクユニット部280を通過する。スクライブ済みの貼り合わせマザー基板90はスチームプレイクユニット部280を通過することで貼り合わせマザー基板90が分断され、ベルトコンベア285に支持される状態となる。

# [0262]

スチームブレイクユニット部280を通過することで貼り合わせマザー基板90は複数のパネル基板90に分断され、ベルトコンベア285に支持される状態となった移動中および停止中のパネル基板90aは搬出ロボット310により取り上げられて、パネル反転ユニット部320の反転搬送ロボット321のパネル保持部322に載置される。

### [0263]

パネル反転ユニット部320の反転搬送ロボット321は、基板搬送ユニット部の搬送ロボット310からパネル基板90aを受け取り、パネル基板90aの表裏を反転してパネル端子分離部340の分離テーブル341上に載置する。

# [0264]

反転搬送ロボット321によりパネル端子分離部340の分離テーブル341上に載置されたパネル基板90aは、例えば挿入ロボット(不図示)により図40に示すような分離テーブル341の各側縁部付近に設けられた不要部分除去機構342によりパネル基板90aの不要部99をパネル基板90aから分離される。

#### [0265]

尚、スクライブ装置ガイド体242の上部基板分断装置60および下部基板分断装置70によるスクライブ方法に実施の形態1の図24乃至図33で示すスクライブ方法を用いることにより、スチームブレイクユニット部280による貼り合わせマザー基板90の分断工程を省略することができる。

### [0266]

また、基板を分断する方法としては、上述のようにマザー基板が脆性材料基板の一種であるガラス基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板に二重のスクライブライン形成する方法を一例として説明したが、これに限らない。マザー基板が、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板、およびセラミクス基板、ガラス基板、半導体基板等の脆性材料基板である場合には、例えばレーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、切断刃 ダイヤモンドカッター等を用いたマザー基板の分断方法が用いられる。

# [0267]

さらに、基板にはマザー基板の他に、マザー基板同士を組み合わせて貼り合わせた貼り合わせ基板、異なるマザー基板を組み合わせて貼り合わせた貼り合わせ基板、マザー基板を組み合わせて積層させた基板が含まれる。

### [0268]

#### 〈実施の形態3〉

図47は、本発明の基板分断システムの別の実施形態の一例を示す全体概略斜視図である。なお、本発明において、「基板」には、複数の基板に分断されるマザー基板を含み、また、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板およびセラミックス基板、半導体基板、ガラス基板等の脆性材料基板等の単板が含まれる。さらに、このような単板に限らず、一対の基板同士を貼り合わせた貼り合わせ基板、一対の基板同士を積層させた積層基板も含まれる。

#### [0269]

本発明の基板分断システムは、例えば、一対のガラス基板が、相互に貼り合わせられた液晶表示装置のパネル基板(表示パネル用貼り合わせ基板)を製造する際、この基板分断システムによって、一対のマザーガラス基板が相互に貼り合わされた貼り合わせマザー基板90が、複数枚のパネル基板(表示パネル用貼り合わせ基板)に分断される。

#### [0270]

本実施の形態3の基板分断システム400は実施の形態1の基板分断システム1における基板支持装置20が実施の形態3の基板支持装置420に置き換えられ、複数の支持ベルト450が本実施の形態3の基板分断システム内に張られること以外は実施の形態1と同様の構成であるため、図47において実施の形態1と同一の部材については同一の符号で示し、詳細な説明については省略する。

# [0271]

本実施の形態3の基板分断システム400において、第1基板支持部420Aが配置される側を基板搬入側、基板搬出装置80が配置されている側を基板搬出側として以下の説明を行う。また、本発明の基板分断システム400において、基板が搬送されていく方向(基板の流れ方向)は基板搬入側から基板搬出側に向かう+Y方向である。また、この基板が搬送されていく方向はスクライブ装置ガイド体30に対して水平状態で直交する方向であり、スクライブ装置ガイド体30はX方向に沿って設けられる。

基板支持装置 4 2 0 の第 1 基板支持部 4 2 0 A および第 2 基板支持部 4 2 0 B は、例えば、それぞれがスクライブ装置ガイド体 3 0 の移動方向と同方向に移動可能になった 5 つの第 1 基板支持ユニット 4 2 1 A および第 2 基板支持ユニット 4 2 1 B をそれぞれ備えている。各第 1 基板支持ユニット 4 2 1 A および各第 2 基板支持ユニット 4 2 1 B は、それぞれ、メインフレーム 1 1 の長手方向のフレーム 1 1 A および 1 1 B に対して平行な方向(Y方向)に沿った直線状に構成されている。

### [0272]

図49は、第1基板支持部420Aに設けられた1つの第1基板支持ユニット421Aの斜視図である。第1基板支持ユニット421Aは、メインフレーム11と平行な方向(Y方向)に沿って直線状に延びる支持本体部421aを有しており、支持本体部421aの上部に、支持ベルト450を案内するベルト受け421bが備えられ、支持本体部421aの基板搬出側の端部にはプーリ421cおよび421dがそれぞれ取り付けられている。また、支持本体部421aの下部中央部にはシリンダー421hが備えられ、シリンダー421hのシリンダーロッドは吸引板421eと接合されている。さらに、支持本体部421aの下部両端部にはリニアガイド421fが備えられ、それぞれのリニアガイド421fに挿入されるシャフト421gの一方端がそれぞれ吸引板421eと接合される

### [0273]

吸引板421eは、シリンダー421hの駆動により支持ベルト450よりも上方の位置へ移動し、前工程から不図示の搬送装置により第1基板支持部420に搬送される貼り合わせマザー基板90を受け取り、不図示の吸引機構により貼り合わせマザー基板90を吸引して吸着し、第1基板支持ユニット421Aの支持ベルト450上に載置する。

#### [0274]

尚、シリンダー421hは2段シリンダーの構成をしており、シリンダー内へ圧縮空気の投入のパターンを不図示の電磁弁で制御することにより、吸引板421eは、選択的に図48に示す支持ベルト450より下方の最下段の位置、貼り合わせマザー基板90を受け取る最上段の位置および支持ベルト450に貼り合わせマザー基板90を載置する中段の位置とされる。

### [0275]

支柱45が架台10の上面に設けられた一対のガイドレール13のそれぞれの移動ユニットに保持されたガイドベース15の上面に設けられ、その支柱45の上方に、メインフレーム11のフレーム11Aおよび11Bに沿うY方向と平行に支持部材43が設けられる。支持本体部21aはそれぞれの支持部材43にメインフレーム11のフレーム11Aと11Bと直交するX方向に架設される2本のユニット取付部材41および42に、支持本体部21aは接合部材46および47を介して取り付けられる。

#### [0276]

図48は第1基板支持ユニット421Aがスクライブ装置ガイド体30および第2基板支持ユニット421Bとともに基板搬入側へ移動して様子を説明する図である。図49(a)のように基板搬入側のメインフレーム11に接続された支持ベルト450は第1基板支持ユニット421Aのプーリ421cおよび421dに掛けられた後、第1基板支持ユニット421Aのア方のプーリ451,第2基板支持ユニット421Bの下方のプーリ452に掛けられた後、第2基板支持ユニット421Bのプーリ452に掛けられ、第2基板支持ユニット421Bのベルト受け421dおよび421cに掛けられ、第2基板支持ユニット421Bのベルト受け421bに支持された後、基板搬出側のメインフレーム

11に接続されて張られる。

# [0277]

第1基板支持ユニット421Aを支持するフレーム11A側の支柱45とフレーム11B側の支柱45がガイドベース15に保持され、スクライブ装置ガイド体30の両端を支持する支柱28を保持するガイドベース15にリニアモータの可動子(図示せず)が取り付けられているため、リニアモータの駆動により、スクライブ装置ガイド体30が基板搬入側へ移動するとともに、第1基板支持部420Aの5台の第1基板支持ユニット421Aは基板搬入側へ移動する。

### [0278]

第1基板支持ユニット421Aは複数台(本実施例の説明においては5台)、所定の間隔を設けて配置され、スクライブ装置ガイド体30とともにメインフレーム11のフレーム11Aおよび11Bに沿うY方向へ移動する。

## [0279]

基板支持装置 4 2 0 の第 2 基板支持部 4 2 0 Bは、例えば、それぞれがスクライブ装置ガイド体 3 0 の移動方向と同方向に移動可能になった 5 つの第 2 基板支持ユニット 4 2 1 Bを備えている。この第 2 基板支持ユニット 4 2 1 Bは第 1 基板支持ユニット 4 2 1 Aから、吸着板 4 2 1 e と吸着板 4 2 1 e を昇降させるシリンダー 4 2 1 h、リニアガイド 4 2 1 f、シャフト 4 2 1 gを取り除いた構成であり、スクライブ装置ガイド体 3 0 に対して対称となるように、ソ方向の取付け方向が逆になるように、フレーム 1 1 A側の支柱 4 5 とフレーム 1 1 B側の支柱 4 5 に支持され、それぞれの支柱がガイドベース 1 5 に保持されている。

## [0280]

スクライブ装置ガイド体30の両端を支持する支柱28を保持するガイドベース15にリニアモータの可動子(図示せず)が取り付けられているため、リニアモータの駆動により、スクライブ装置ガイド体30が基板搬入側へ移動するとともに、第2基板支持部420Bの5台の第2基板支持ユニット421Bが基板搬入側へ移動する。

### [0281]

図49(b)に示すように第1基板支持ユニット421Aがスクライブ装置ガイド体30および第2基板支持ユニット421Bとともに基板搬入側へ移動すると、第1基板支持ユニット421Aの支持ベルト450はスクライブ装置ガイド体の下方に沈みこみ、第2基板支持ユニット421Bの支持ベルト450はスクライブ装置ガイド体30の下方から第2基板支持ユニット421Bのベルト受け421b上に現れてくる状態となる。また、第2基板支持ユニット421Bがスクライブ装置ガイド体30および第1基板支持ユニット421Aとともに基板搬出側へ移動すると、第2基板支持ユニット421Bの支

ユニット421Aとともに基板搬出側へ移動すると、第2基板支持ユニット421Bの支持ベルト450はスクライブ装置ガイド体30の下方へ沈みこみ、第1基板支持ユニット421Aの支持ベルト450はスクライブ装置ガイド体30の下方から第1基板支持ユニット421Aのベルト受け421b上に現れてくる状態となる。

#### [0282]

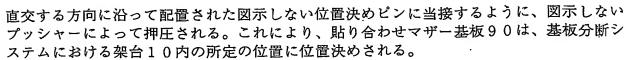
・このような構成の実施の形態3の基板分断システムの動作について、大判のガラス板を 貼り合わせた貼り合わせ基板を分断する場合の一例を主に説明する。

### [0283]

大判のガラス基板が相互に貼り合わせられた貼り合わせマザー基板90を、複数のパネル基板90a(図51参照)に分断する際には、まず、図50に示すように、基板搬入側の端部から、搬送ロボット等によって本基板分断システムに搬入されて、第1基板支持部420Aの全ての第1基板支持ユニット421Aの支持ベルト450に貼り合わせマザー基板90を水平状態で載置する。

## [0284]

このような状態になると、貼り合わせマザー基板90は、実施の形態1と同様に、メインフレーム11のフレーム111Bに沿って配置された図示しない位置決めピンに当接するように、図示しないプッシャーによって押圧されるとともに、そのフレーム11Bとは



## [0285]

その後、図50に示すように貼り合わせマザー基板90は、クランプ装置50の各クランプ具51によって、メインフレーム11のフレーム11Bに沿った側縁部がそれぞれクランプされるとともに、基板搬入側にフレーム11Bとは直交するように配置されたクランプ装置50の各クランプ具51によって、基板搬入側に位置する貼り合わせマザー基板90の側縁部がクランプされる。

### [0286]

貼り合わせマザー基板90の相互に直交する各側縁部がそれぞれクランプ装置50によってクランプされると、貼り合わせマザー基板90の側縁部をクランプしている各クランプ具51が貼り合わせマザー基板の自重によりほぼ同時に沈み込むため、貼り合わせマザー基板90が全ての第1基板支持ユニット421Aの支持ベルト450によって補助的に支持された状態とされる。

### [0287]

このような状態になると、スクライブ装置ガイド体30が、クランプ装置50によって水平状態にクランプされた貼り合わせマザー基板90における基板搬出側の側縁部上の所定位置になるように、基板搬入側にスライドされる。そして、スクライブ装置ガイド体30に設けられた第1光学装置38および第2光学装置39がそれぞれの待機位置からスクライブ装置ガイド体30に沿って移動することにより、それぞれ貼り合わせマザー基板90に設けられた第1アライメントマークと第2アライメントマークを撮像する。

# [0288]

スクライブ装置ガイド体30がスライドすることにより、第1基板支持部420Aが、 基板搬入側端部にスライドされ、第2基板支持部420Bが基板搬入側へスライドされる 。このとき、第1基板支持ユニット421Aのスクライブ装置ガイド体30側の支持ベル ト450はスクライブ装置ガイド体30の下方へ沈みこみ、第2基板支持ユニット421 Bの支持ベルト450はスクライブ装置ガイド体30の下方から第2基板支持ユニット4 21Bのベルト受け421b上に現れてくるため、支持ベルト450は貼り合わせマザー 基板90の下面と摺接しない。

### [0289]

次に、第1アライメントマークと第2アライメントマークの撮像結果に基づいて、図示しない演算処理装置によりクランプ装置50によって水平状態で支持された貼り合わせマザー基板90のスクライブ装置ガイド体30に沿った方向に対する傾き、分断開始位置と分断終了位置を演算によって求め、その演算結果に基づいて、上部基板分断装置60および下部基板分断装置70とともに、スクライブ装置ガイド体30も移動させて貼り合わせマザー基板90を分断する。(これを直線補間によるスクライブあるいは分断と呼ぶ)

この場合、図51に示すように、貼り合わせマザー基板90の表面および裏面にそれぞれ対向したカッターホイール62aを、各表面および裏面にそれぞれ圧接して転動させることにより、貼り合わせマザー基板90の表面および裏面にスクライブライン95が形成される。

### [0290]

貼り合わせマザー基板90は、例えば、上側ガイドレール31および下側ガイドレール32に沿った列方向に2つのパネル基板90aを、2列にわたって分断するようになっており、貼り合わせマザー基板90から4個のパネル基板90aを分断するために、パネル基板90aの側縁に沿って、上部基板分断装置60のカッターホイール62aおよび下部基板分断装置70のカッターホイール62aをそれぞれ圧接させて転動させる。

#### [0291]

この場合、上部基板分断装置60のカッターホイール62aと、下部基板分断装置70のカッターホイール62aにより、各ガラス基板における各カッターホイール62aの転

接部分にそれぞれ垂直クラックが生成されてスクライブライン95が形成される。しかも、各カッターホイール62aの刃先には、刃先の外周稜線に所定のピッチで突起部がそれぞれ形成されているために、各ガラス基板には、厚さ方向にガラス基板の厚さの約90%の長さの垂直クラックが形成される。

### [0292]

また、貼り合わせマザー基板90をスクライブするダイヤモンドポイントカッターやカッターホイールなどのスクライブカッターを振動させて、スクライブカッターによる貼り合わせマザー基板90への押圧力を周期的に変化させる機構を備えるカッターヘッドを用いてスクライブ方法も本発明の基板分断システムの貼り合わせマザー基板の分断に有効に適用される。

さらに、上部基板分断装置60のカッターホイール62aおよび下部基板分断装置70のカッターホイール62aをそれぞれ圧接させて転動させて貼り合わせマザー基板90から4枚のパネル基板90aを分断させるために、4枚のパネル基板90aの側縁部にスクライブラインを形成するスクライブ方法としては、図44で示すものとは別に実施の形態1の図19乃至図21に示すスクライブ方法も本実施の形態2の基板分断システムに有効に適用することができる。

尚、上部基板分断装置60のカッターホイール62aおよび下部基板分断装置70によるスクライブ中、第1基板支持部420Aの全ての第1基板支持ユニット421Aと第2基板支持部420Bの全ての第2基板支持ユニット421Bは基板搬入側および基板搬出側へ移動するが、基板搬入側へ移動するとき、第1基板支持ユニット421Aのスクライブ装置ガイド体30側の支持ベルト450はスクライブ装置ガイド体30の下方へ沈みこみ、第2基板支持ユニット421Bの支持ベルト450はスクライブ装置ガイド体30の下方から第2基板支持ユニット421Bのベルト受け421b上に現れてくる状態となり、基板搬出側へ移動するとき、第2基板支持ユニット421Bの支持ベルト450はスクライブ装置ガイド体30の下方へ沈みこみ、第1基板支持ユニット421Aのベルト450はスクライブ装置ガイド体30の下方より第1基板支持ユニット421Aのベルトそりはスクライブ装置ガイド体30の下方より第1基板支持ユニット421Aのベルト受け421b上に現れてくる状態となるため、支持ベルト450が貼り合わせマザー基板90下面を摺接するおそれはない。

上述のスクライブ方法で貼り合わせマザー基板にスクライブラインを形成した後、図52に示すように、第2基板支持ユニット42.1Bの支持ベルト450によって、スクライブライン95が形成されたマザー貼り合わせ基板90が支持された状態で、スチームユニット部160が基板搬入側へ移動して、スクライブラインが刻まれた貼り合わせマザー基板90の表裏面全体に蒸気を吹きかけて、貼り合わせマザー基板90を完全に分断させるとともに、蒸気を吹きかけた後に貼り合わせマザー基板90の表裏面に残存する水分をエアーナイフ165で除去する。

スクライブラインが刻まれた貼り合わせマザー基板 9 0 の表裏面全体に蒸気を吹きかけることにより、カッターホイール 6 2 a によって形成されたスクライブラインは、マザーガラス基板 1 の表面部分が加熱されて体積膨張することによって、垂直クラックは、マザー基板の厚み方向に伸展し、貼り合わせマザー基板 9 0 が完全に分断される。

### [0293]

その後、図52に示すように、第2基板支持部420Bの全ての第2基板支持ユニット421Bの支持ベルト950上の貼り合わせ基板90から分断された全ての表示パネル90aが、基板搬出装置80の搬出ロボット140によって搬出されることにより、分断された貼り合わせマザー基板90'(端材)が支持される。

# [0294]

そして、基板搬出装置80およびスチームユニット部160が基板搬出側の端部に移動 する。

その後、図53に示すように、スクライブ装置ガイド体30、第2基板支持部420Bおよび第1基板支持部420Aが基板搬出側にスライドされる。このとき、第2基板支持ユニット421Bのスクライブ装置ガイド体30側の支持ベルト450はスクライブ装置ガ

イド体30の下方へ沈みこみ、第1基板支持ユニット421Aの支持ベルト450はスクライブ装置ガイド体30の下方より第1基板支持ユニット421Aのベルト受け421b上に現れてくるため分断された貼り合わせマザー基板90'(端材)の下面が支持ベルト450と摺接するおそれはない。

# [0295]

このため、第1基板支持ユニット421Aの支持ベルト450と第2基板支持部420Bの第2基板支持ユニット421Bの支持ベルトは分断された貼り合わせマザー基板90'(端材)の下面から、摺接することなく、順次、非接触状態となり、支持ベルト450による分断された貼り合わせマザー基板90'(端材)の支持が順次解除される。そして、分断された貼り合わせマザー基板90'(端材)は、クランプ装置50による保持が解除され、分断された貼り合わせマザー基板90'(端材)は、下方に落下する。この場合、下方に落下した分断された貼り合わせマザー基板90'(端材及びカレット)は、傾斜状態で配置されたガイド板によって案内されてカレット収容ボックス内に収容されるようになっている。

尚、スクライブ装置ガイド体30の上部基板分断装置60および下部基板分断装置70によるスクライブ方法に実施の形態1の図24乃至図33で示すスクライブ方法を用いることにより、スチームユニット部160による貼り合わせマザー基板90の分断工程を省略することができる。

# [0296]

また、基板を分断する方法としては、上述のようにマザー基板が脆性材料基板の一種であるガラス基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板に二重のスクライブライン形成する方法を一例として説明したが、これに限らない。マザー基板が、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板、およびセラミクッス基板、ガラス基板、半導体基板等の脆性材料基板である場合には、例えばレーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、切断刃 ダイヤモンドカッター等を用いたマザー基板の分断方法が用いられる。

# [0297]

さらに、基板にはマザー基板の他に、マザー基板同士を組み合わせて貼り合わせた貼り合わせ基板、異なるマザー基板を組み合わせて貼り合わせた貼り合わせ基板、マザー基板を組み合わせて積層させた基板が含まれる。

### [0298]

### 〈実施の形態4〉

図54に示す基板製造装置801は、分断された基板の端面部を面取りする基板面取りシステム600を本発明の基板分断システム1、200および400のいずれか1台の基板分断システムに接続させたものである。

### [0299]

さらに、図55に示す基板製造装置802および803は、分断された基板のサイズ及びその表裏面と端面部の状況等を検査したり、その基板の機能を検査する検査システム700を上述の基板製造装置801に組み込だものである。

### [0300]

尚、上述の実施の形態1万至3の基板分断システムの動作の説明においては、ガラス基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板を分断する場合を一例として述べてきたが、これに限定されるものではない。例えば、分断される基板の種類や基板分断システムを構成する各装置の機能性を高めるためなどにより、上述の説明とは異なった動作を実施させる場合もある。

# [0301]

これまでの実施の形態1乃至3の説明においては、主に、ガラス基板が相互に貼り合わされた貼り合わせマザー基板を複数枚の表示パネルに分断する基板分断システムについて説明してきたが、本発明に適用できる基板はこれに限るものではない。

# [0302]

本発明の基板分断システムに適用される基板には、マザー基板が鋼板等の金属基板、木

板、プラスチック基板、セラミックス基板や半導体基板並びにガラス基板等を包含する脆性材料基板等が含まれ、さらに、マザー基板を組み合わせて貼り合わせた貼り合わせ基板、異なるマザー基板を組み合わせて貼り合わせた基板、マザー基板同士を組み合わせて積層させた基板が含まれる。

### [0303]

また、脆性材料基板同士を貼り合わせた貼り合わせ脆性材料基板として、FPD(フラットパネルディスプレイ)に用いられるPDP(プラズマデイスプレイ)、液晶表示パネル、反射型プロジェクターパネル、透過型プロジェクターパネル、有機EL素子パネル、FED(フィールドエミッションディスプレイ)等のマザー基板の分断においても、本発明の基板分断システムが適用できる。

### 【産業上の利用可能性】

### [0304]

液晶表示装置等の表示パネルに使用されるガラス基板等のマザー基板を含む、種々の材料のマザー基板を分断するために使用される基板分断システムおよび基板分断ラインシステムの分野において、その目的は、設置面積を小さくしてコンパクトであり、また、各種マザー基板を効率よく分断することができることである。

### 【図面の簡単な説明】

# [0305]

- 【図1】本発明の実施の形態1の基板分断システムの一例を示す概略斜視図である。
- 【図2】その基板分断システムの他の方向からの概略斜視図である。
- 【図3】その基板分断システムの要部を拡大した概略斜視図である。
- 【図4】その基板分断システムの他の要部を拡大した概略斜視図である。
- 【図5】(a)は基板搬出装置の搬出ロボットの構成を示す概略構成図、(b)は搬出ロボットの動作を説明する説明図である。
- 【図 6 】 その基板分断システムの基板支持装置に設けられた第 1 基板支持ユニットの側面図である。
- 【図7】その基板分断システムのスクライブ装置ガイド体側から第1基板支持部を見たときの正面図である。
- 【図8】その基板分断システムの基板支持部に設けられたクラッチユニットの概略構成図である。
  - 【図9】そのクラッチユニットの側面図である。
- 【図10】本発明の実施の形態1の基板分断システムのスチームユニット部を基板搬 入側から見たときの要部の正面図である。
- 【図11】そのスチームユニット部のスチームユニットの構造を示す部分側面断面図である。
- 【図12】本発明の実施の形態1の基板分断システムに設けられるクランプ装置の構成を示し、動作説明のための斜視図である。
- 【図13】本発明の実施の形態1の基板分断システムに設けられるクランプ装置の構成を示し、動作説明のための斜視図である。
- 【図14】本発明の実施の形態1の基板分断システムの基板分断装置に具備されるカッターヘッドの一例を示す側面図である。
- 【図15】そのカッターヘッドの主要部の正面図である。
- 【図16】本発明の実施の形態1の基板分断システムの基板分断装置に具備されるカッターヘッドの別の一例を示す正面図である。
- 【図17】本発明の実施の形態1の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図である。
- 【図18】本発明の実施の形態1の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図である。
- 【図19】本発明の実施の形態1の基板分断システムおいて、基板をスクライブする ときのスクライブパターンを示す図である。

- 【図20】本発明の実施の形態1の基板分断システムおいて、基板をスクライブするときの別のスクライブパターンを示す図である。
- 【図21】本発明の実施の形態1の基板分断システムおいて、基板をスクライブする ときのさらに別のスクライブパターンを示す図である。
- 【図22】本発明の実施の形態1の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図である。
- 【図23】本発明の実施の形態1の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図である。
- 【図24】本発明の基板分断方法の原理を説明するための基板の断面図である。
- 【図 2 5】本発明の基板分断方法の一例を説明するための基板のスクライブパターン を示す基板の平面図である。
- 【図26】本発明の基板分断方法の別の一例を説明するための基板のスクライブパタ ーンを示す基板の平面図である。
- 【図27】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライブパターンを示す基板の部分平面図である。
- 【図28】(a)および(b)は本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライブパターンを示す基板の平面図である。
- 【図29】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライブパターンを示す基板の平面図である。
- 【図30】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライブパターンを示す基板の部分平面図である。
- 【図31】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライブパターンを示す基板の平面図である。
- 【図32】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための平面図である。
- 【図33】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライ ブパターンを示す基板の平面図である。
- 【図34】本発明の実施の形態2の基板分断システムの一例を示す全体概略斜視図である。
  - 【図35】その基板分断システムを示す概略平面図である。
  - 【図36】その基板分断システムを示す概略側面図である。
- 【図37】本発明の実施の形態2の基板分断システムの位置決めユニット部を示す概略斜視図である。
- 【図38】本発明の実施の形態2の基板分断システムのリフトコンベア部の概略平面 図である。
- 【図39】そのリフトコンベア部の第3基板支持ユニットの側面図である。
- 【図40】本発明の実施の形態2の基板分断システムのパネル端子分離部を説明する 模式図である。
- 【図41】本発明の実施の形態2の基板分断システムの動作説明のための概略部分平面模式図である。
- 【図42】本発明の実施の形態2の基板分断システムの動作説明のための概略部分平面模式図である。
- 【図43】本発明の実施の形態2の基板分断システムの動作説明のための概略部分平面模式図である。
- 【図44】本発明の実施の形態2の基板分断システムの動作説明のための概略部分平面模式図である。
- 【図45】本発明の実施の形態2の基板分断システムの動作説明のための概略部分平面模式図である。
- 【図46】本発明の実施の形態2の基板分断システムの動作説明のための概略部分側面模式図である。
- 【図47】本発明の実施の形態3の基板分断システムの一例を示す全体概略斜視図で

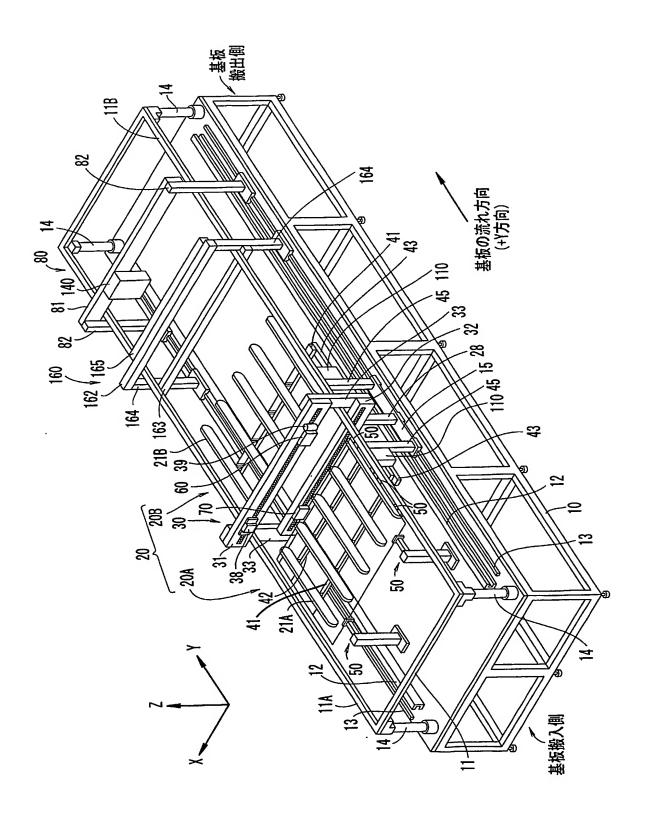
ある。

- 【図48】その基板分断システムの基板支持装置の第1基板支持ユニットの概略斜視 図である。
- 【図49】その基板分断システムの基板支持装置の動作説明のための側面図である。
- 【図50】本発明の実施の形態3の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図である。
- 【図51】本発明の実施の形態3の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図である。
- 【図52】本発明の実施の形態3の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図である。
- 【図53】本発明の実施の形態3の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図である。
- 【図54】実施の形態1~3の基板分断システムを用いた本発明の基板製造装置の構成の一例を示す概略図である。
- 【図55】実施の形態1~3の基板分断システムを用いた本発明の基板製造装置の構成の他の例を示す概略図である。
- 【図56】従来のスクライブ装置の構成を示す正面図である。

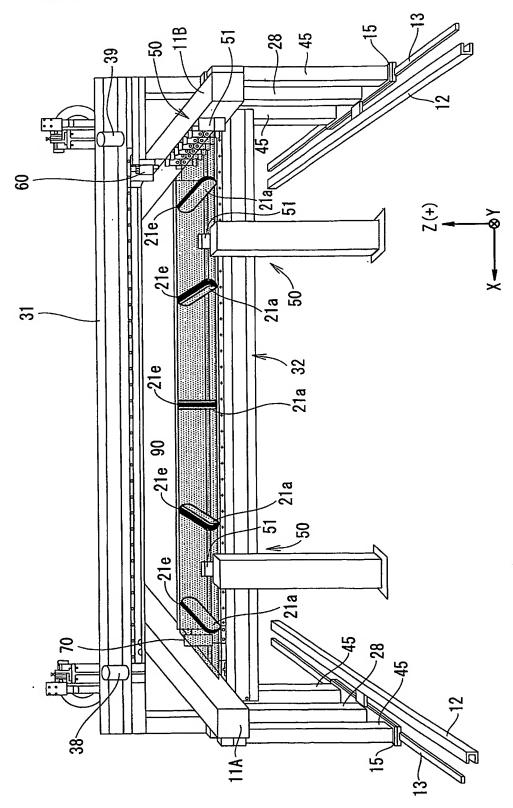
### 【符号の説明】

- [0306]
- 10 架台
- 20 基板支持装置
- 20A 第1基板支持部
- 20B 第2基板支持部
- 21A 第1基板支持ユニット
- 21B 第2基板支持ユニット
- 30 分断装置ガイド体
- 40 基板昇降装置
- 50 クランプ装置
- 60 上部基板分断装置
- 70 下部基板分断装置
- 80 基板搬出装置
- 90 貼り合わせマザー基板
- 220 位置決めユニット部
- 240 スクライブユニット部
- 260 リフトコンベア部
- 280 スチームプレイクユニット部
- 300 基板搬送ユニット部
- 320 パネル反転ユニット部
- 340 パネル端子分離部
- 420 基板支持装置
- 450 支持ベルト

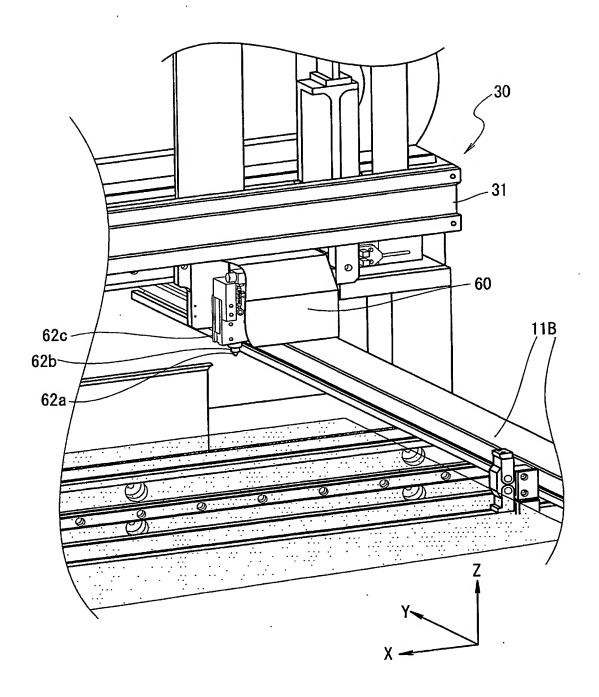
【書類名】図面 【図1】



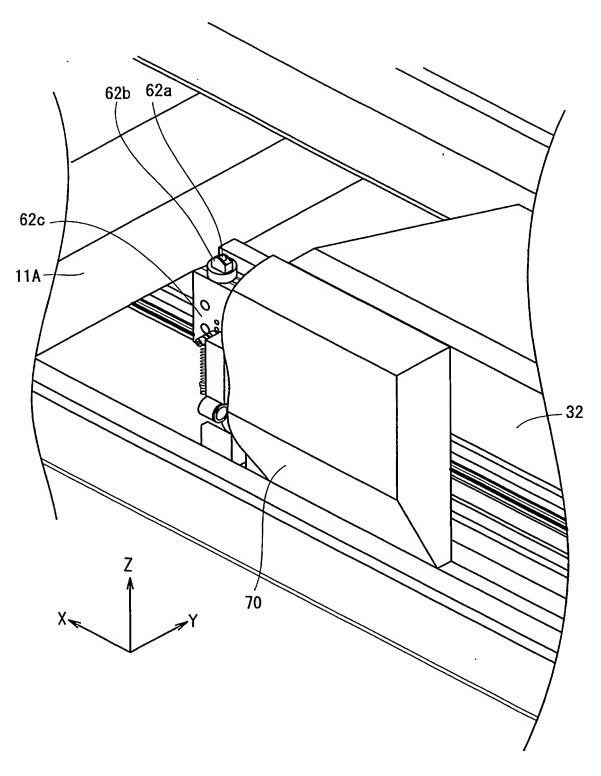




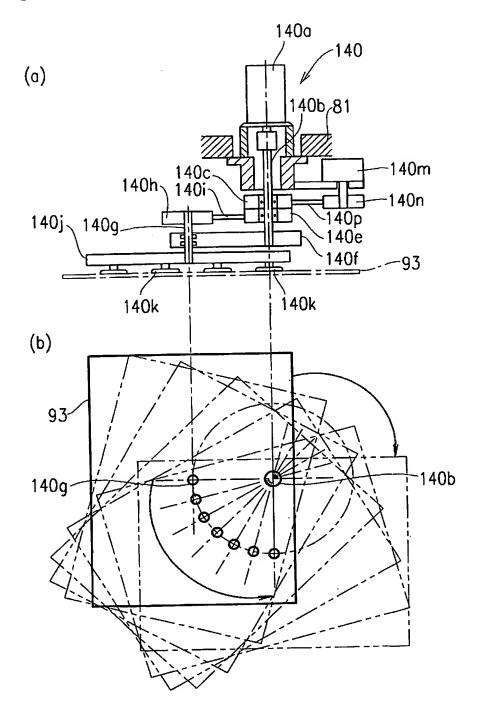




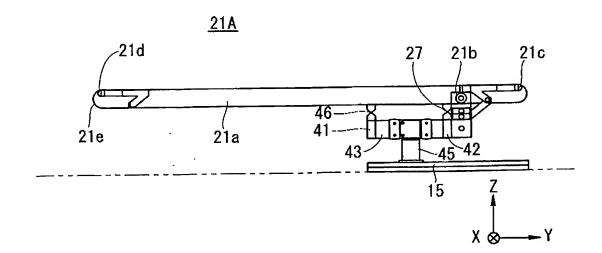




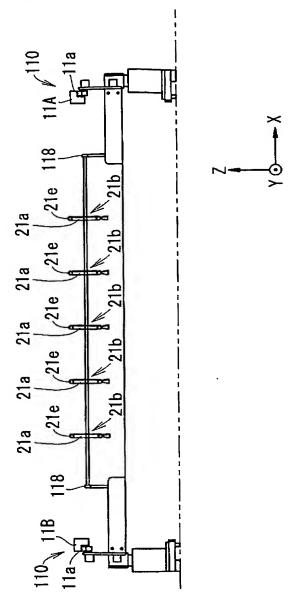
【図5】



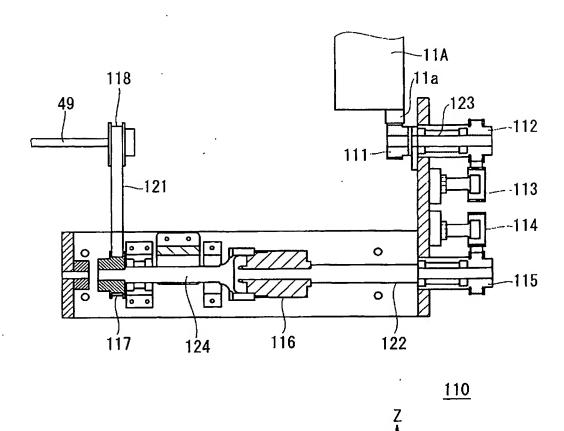
【図6】



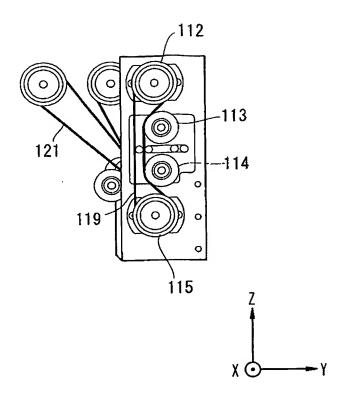






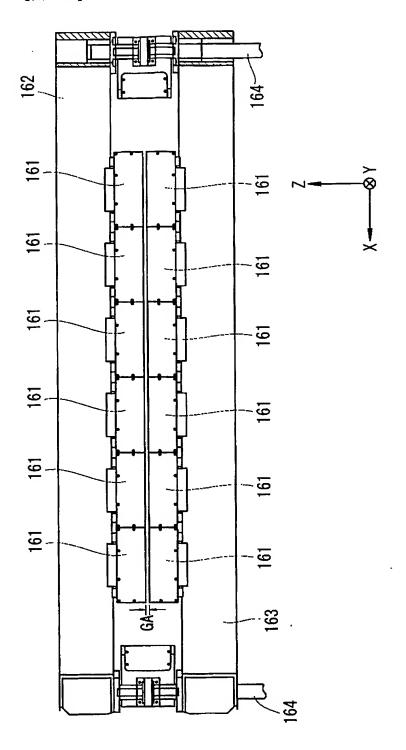




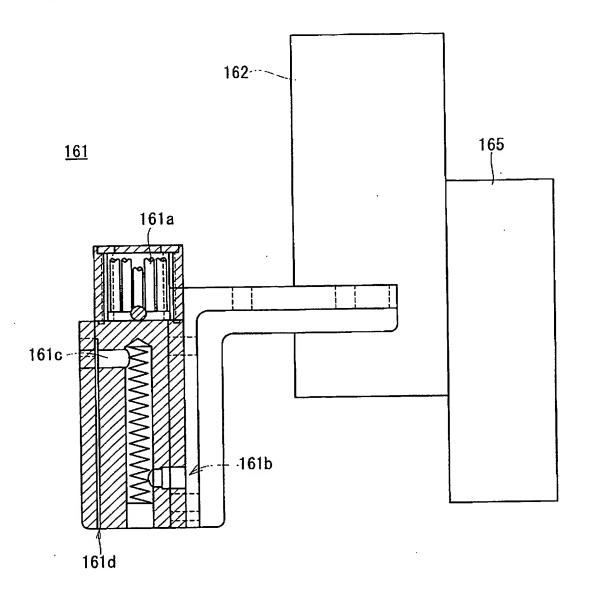




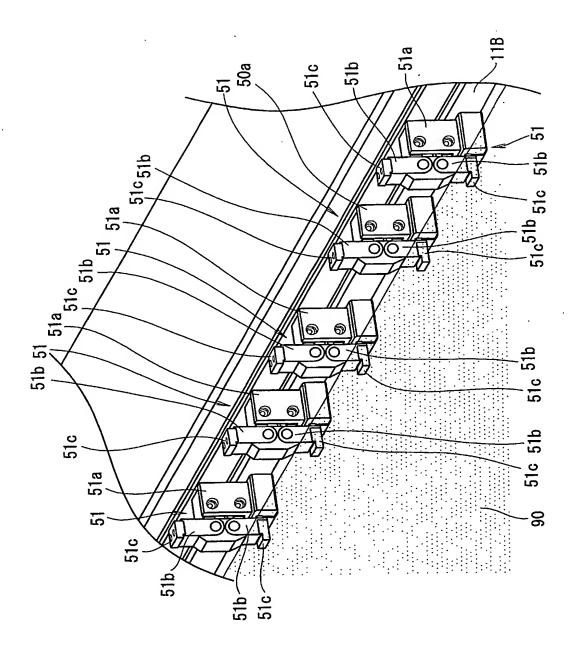
【図10】



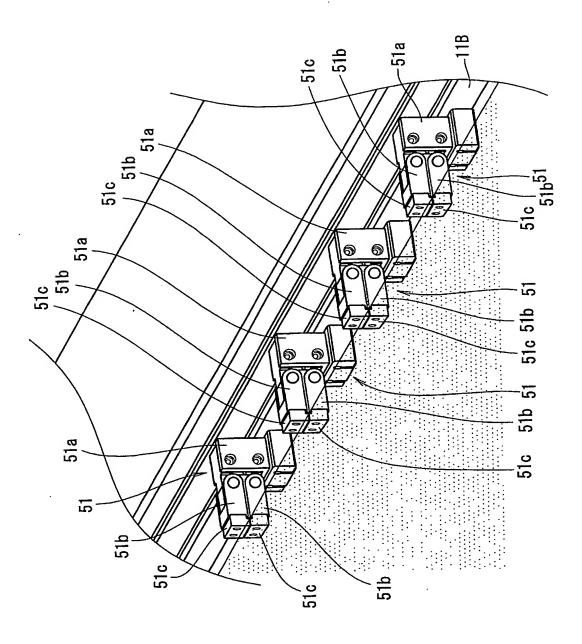




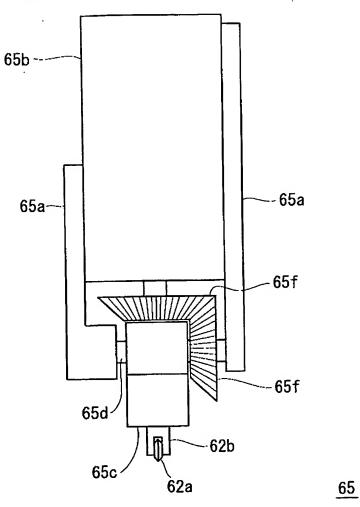
【図12】



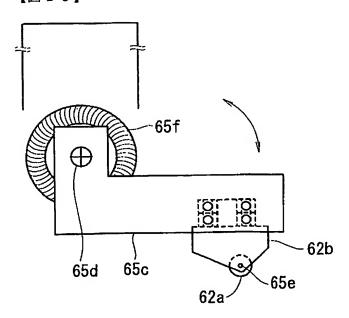




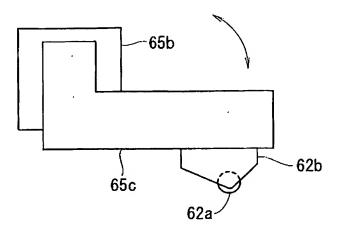




【図15】

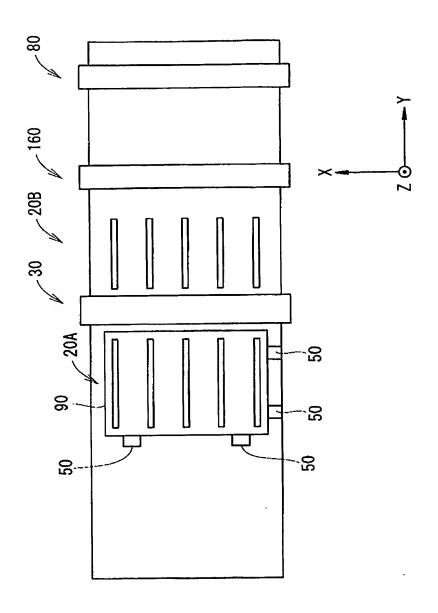


【図16】



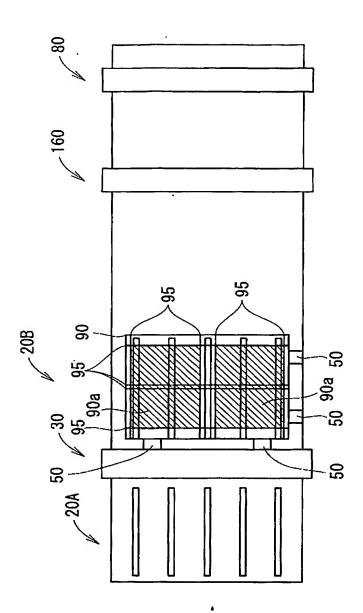
16/



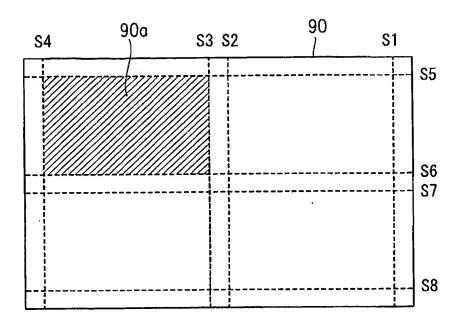




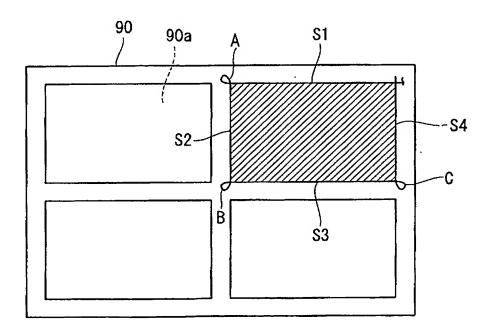
【図18】



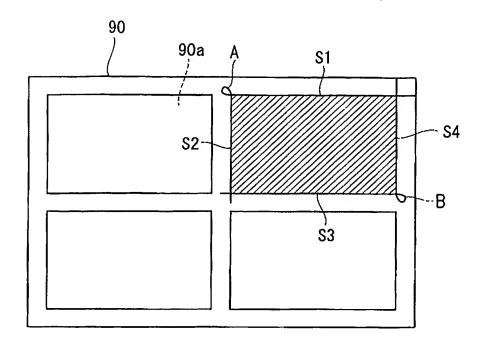




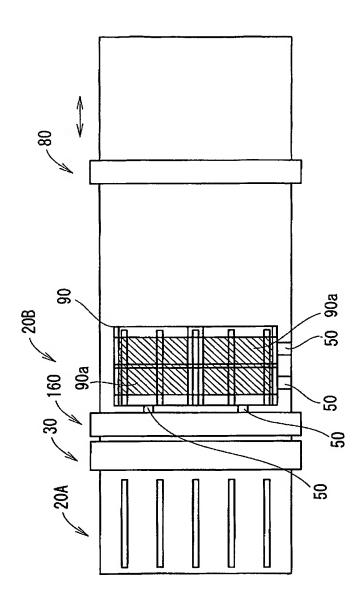
【図20】



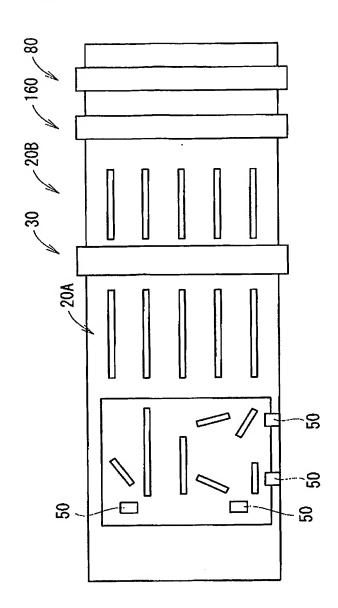
【図21】



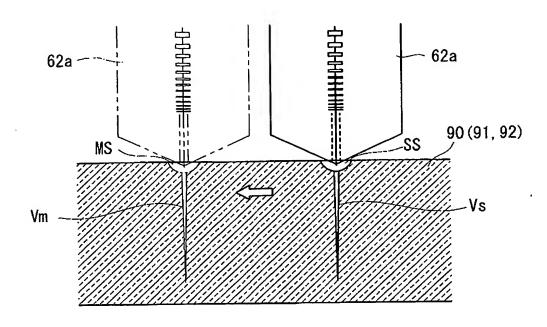




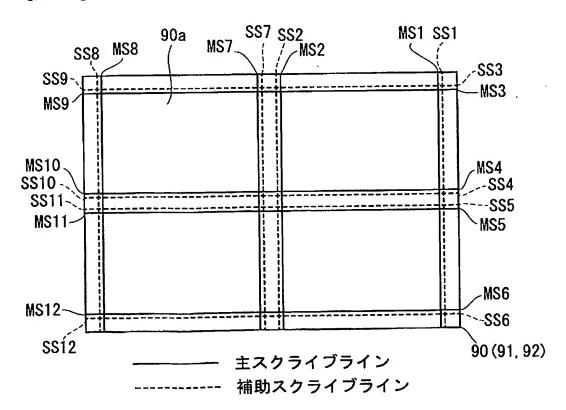
【図23】



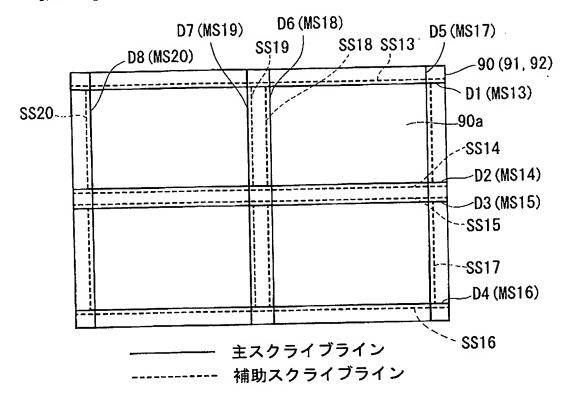
【図24】



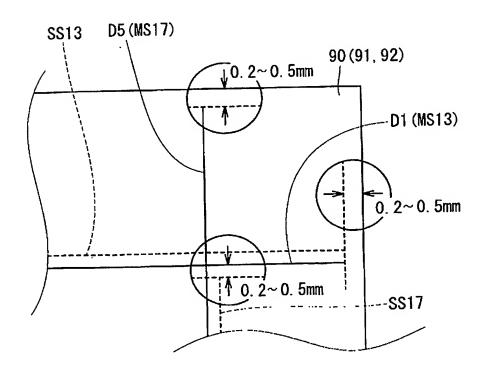
【図25】



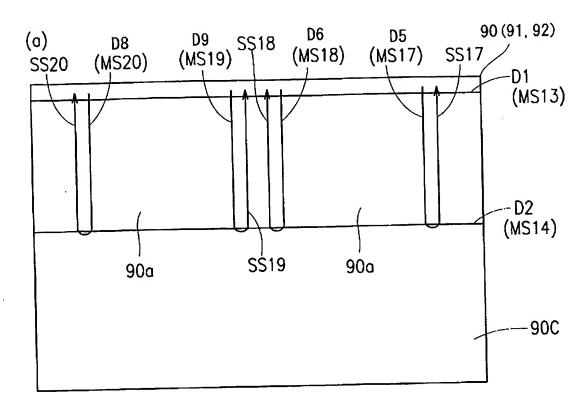
【図26】

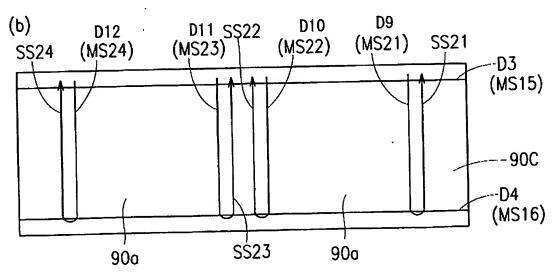


【図27】

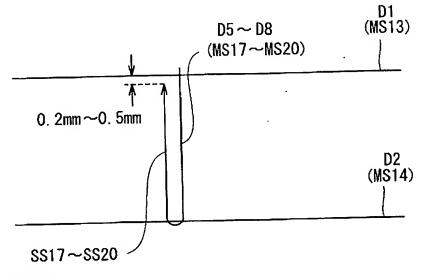


【図28】

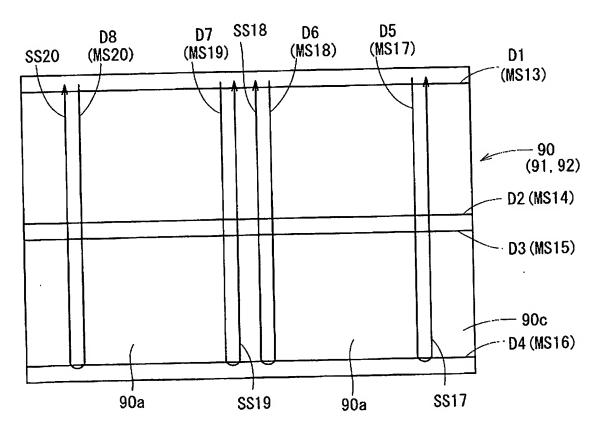




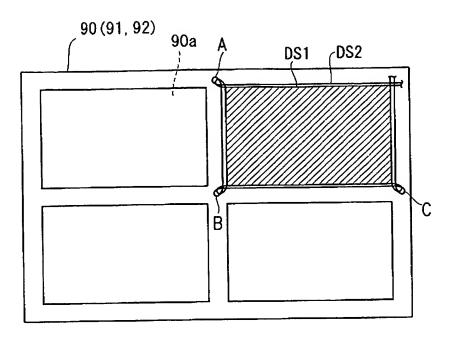
【図29】



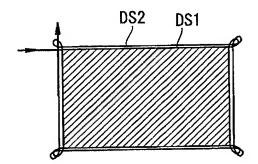
【図30】



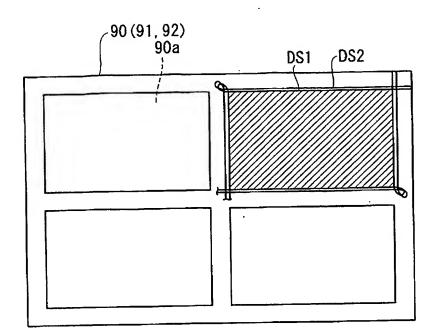




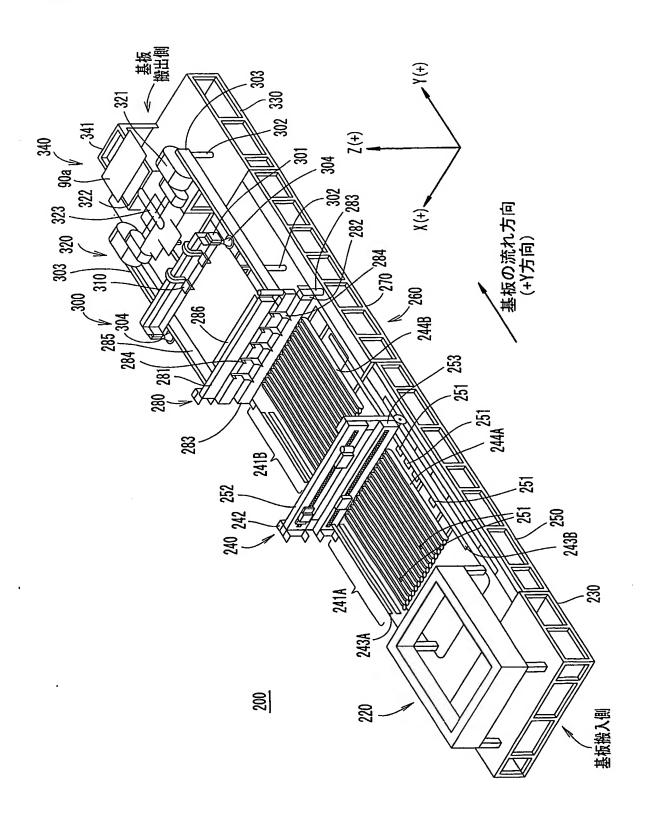
【図32】



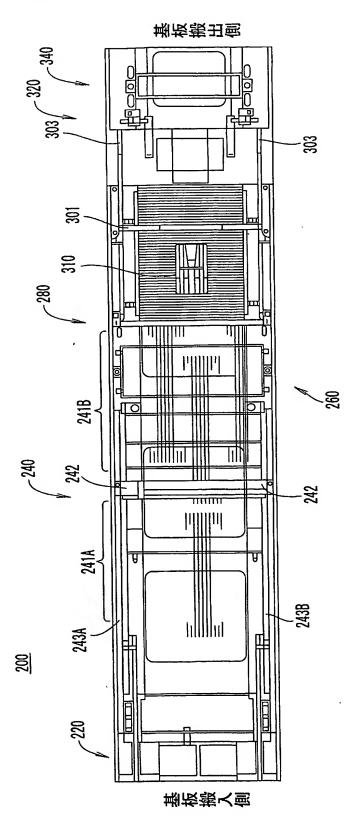
【図33】



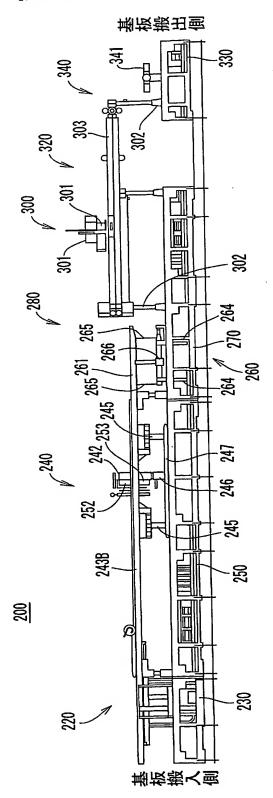




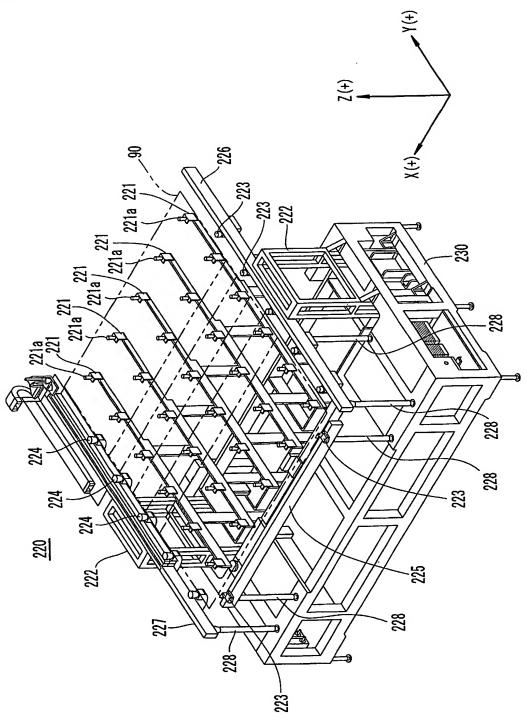




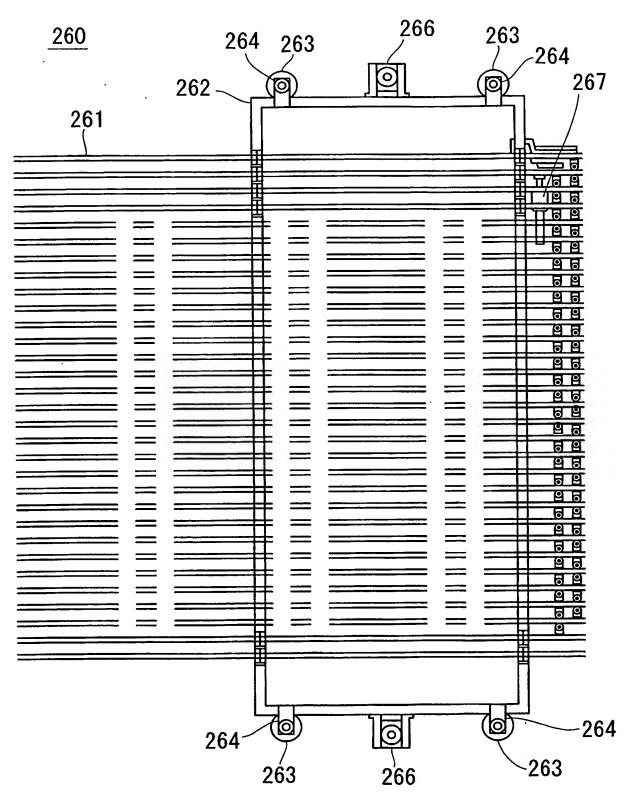
【図36】



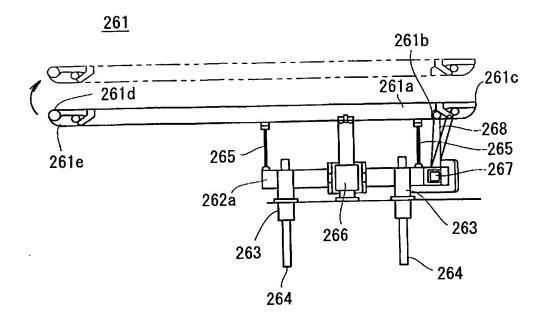




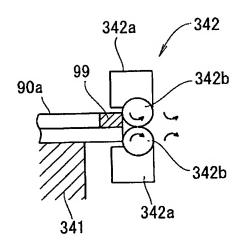
【図38】



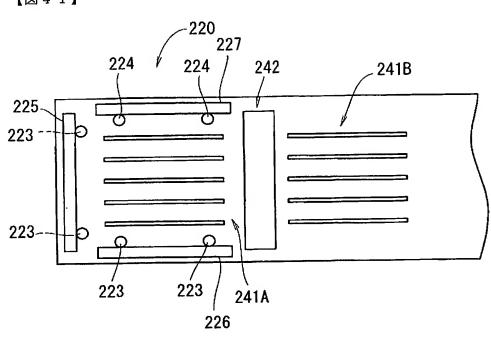
## 【図39】



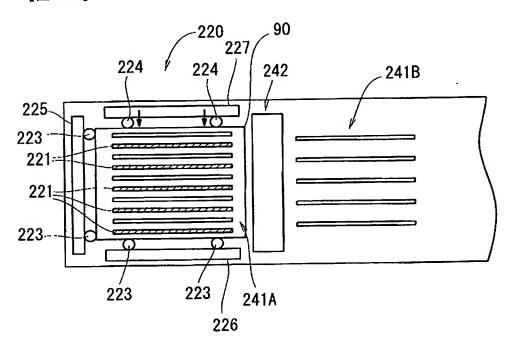
[図40]



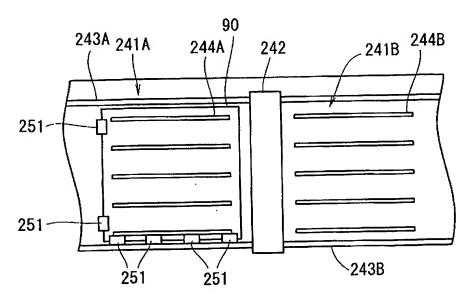
【図41】



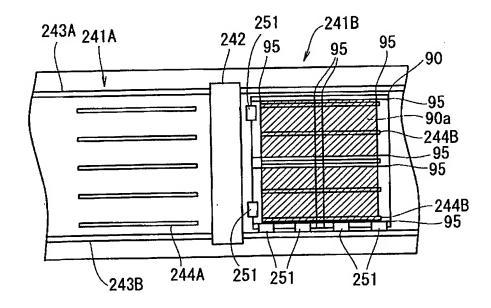
[図42]



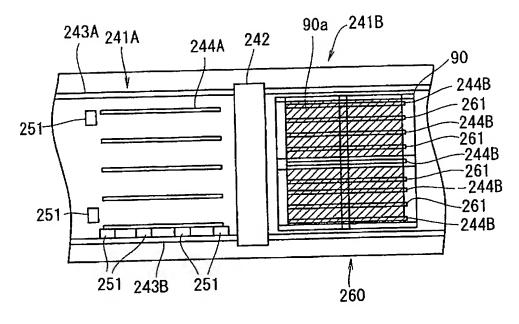
【図43】



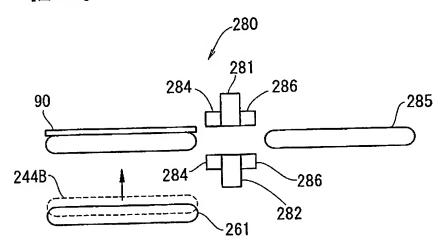
【図44】

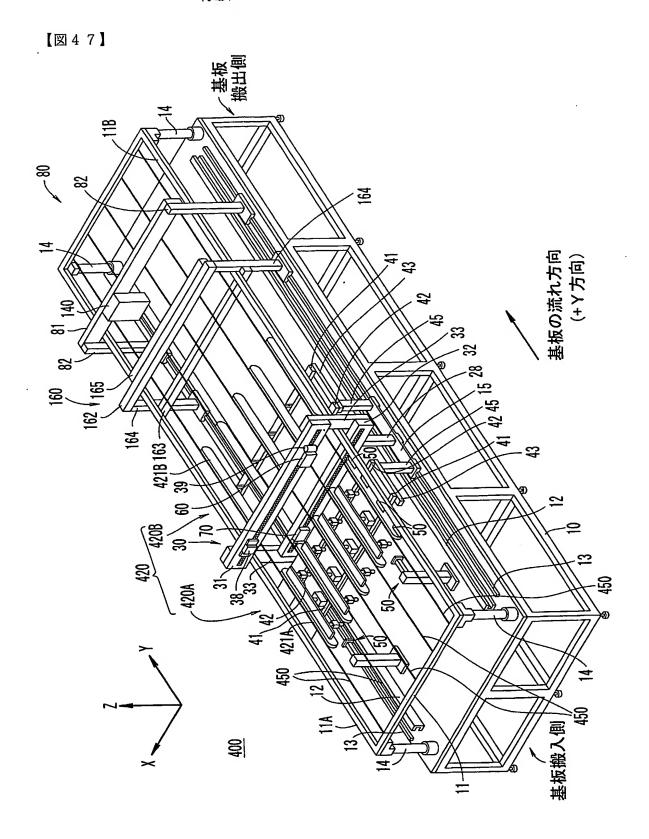


【図45】

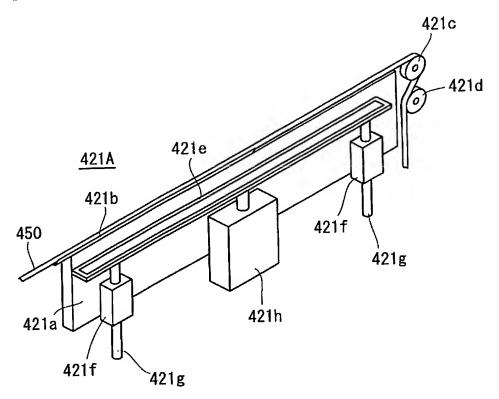


【図46】

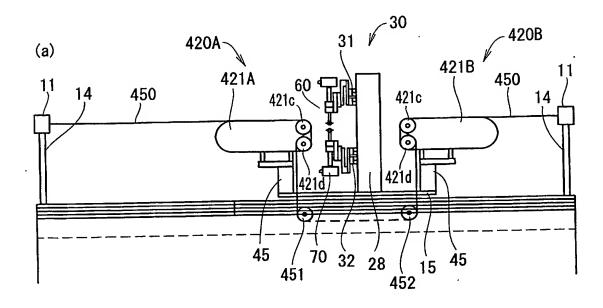


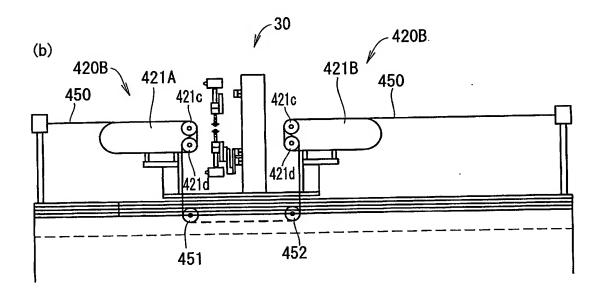


【図48】

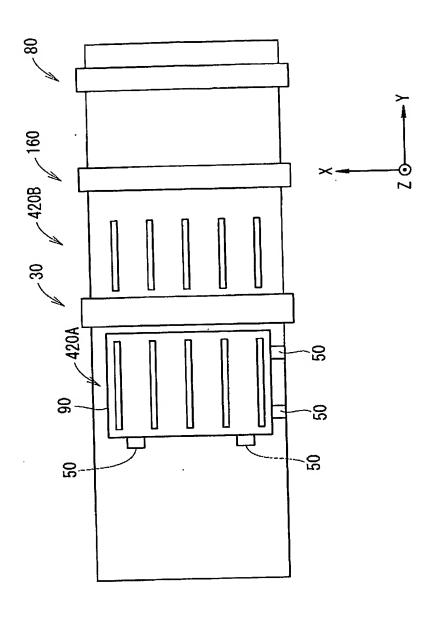


【図49】

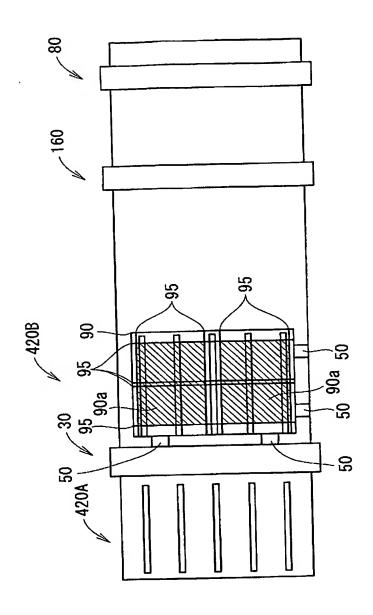




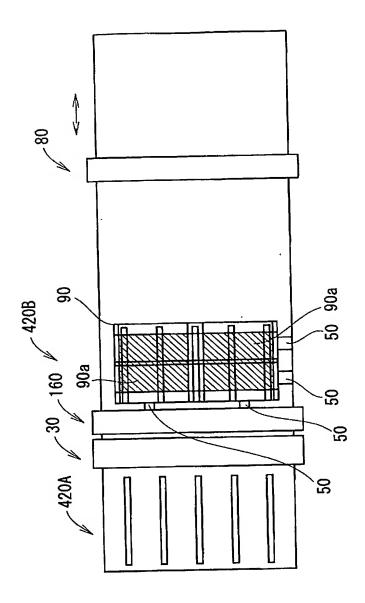




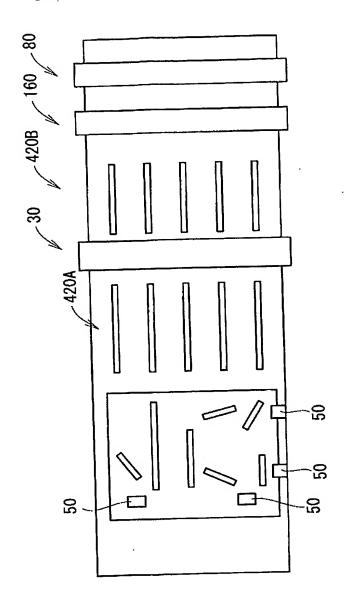
【図51】



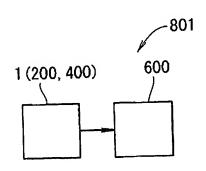
【図52】



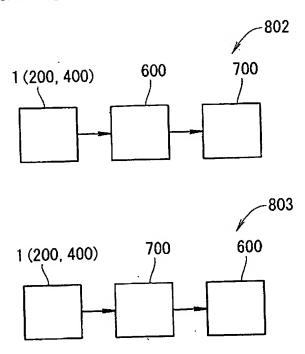




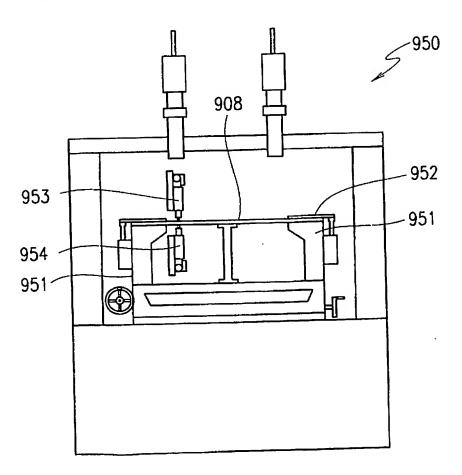
【図54】



【図55】



【図56】





【要約】

配置面積を小さくしてコンパクトであり、しかも基板を効率よく分断すること 【課題】 が出来る基板分断システムを提供する。

【解決手段】 中空直方体状の架台10内に搬入されるマザー基板の少なくとも一箇所側 縁部をクランプするように、架台10にクランプ装置50が取り付けられている。クラン プ装置50にてクランプされたマザー基板の上面および下面からそれぞれマザー基板を分 断させる一対の基板分断装置が、スクライブ装置ガイド体30に設けられており、スクラ イブ装置ガイド体30が、中空直方体の架台の一辺に沿って往復移動可能になっており、 一対の基板分断装置がその移動方向とは直交する方向に沿って移動可能に取り付けられて いる。クランプ装置によってクランプされたマザー基板は、基板支持装置20によって支 持される。

【選択図】 図 1 特願2003-332416

出願人履歴情報

識別番号

[390000608]

1. 変更年月日

2002年 2月 5日

[変更理由]

住所変更

住所氏名

大阪府吹田市南金田2丁目12番12号

三星ダイヤモンド工業株式会社